

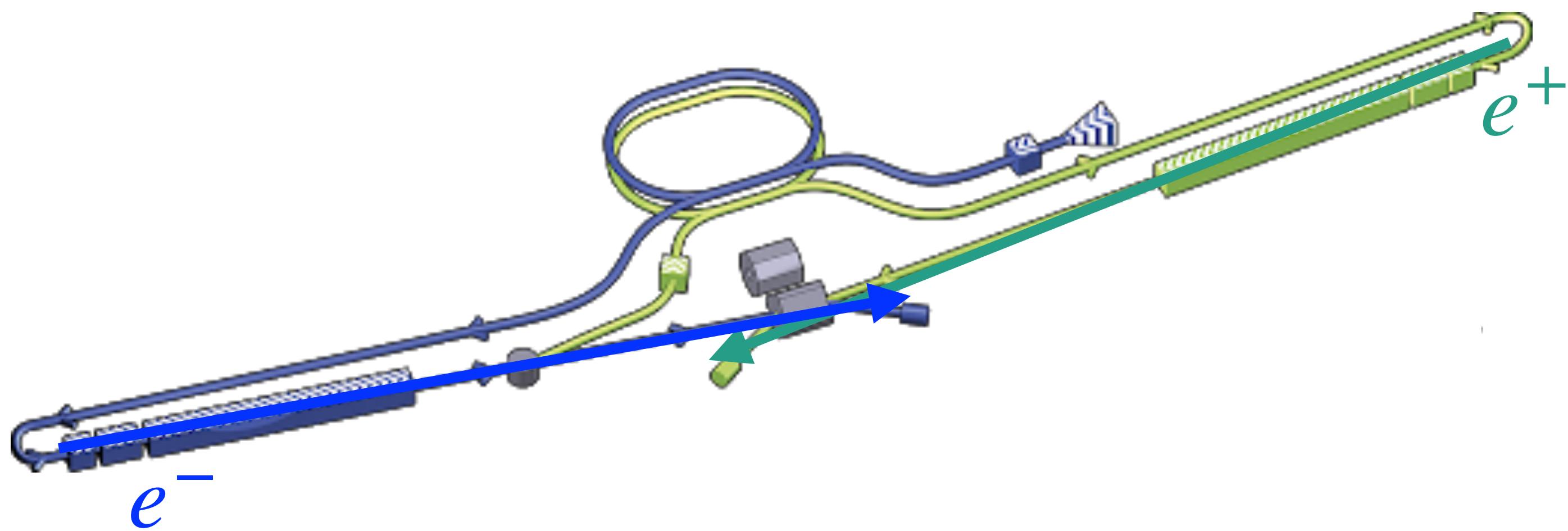
# **New physics searches at the ILC positron and electron beam dumps**

Based on [2105.13768](#)

with Kento Asai, Sho Iwamoto and Yasuhito Sakaki

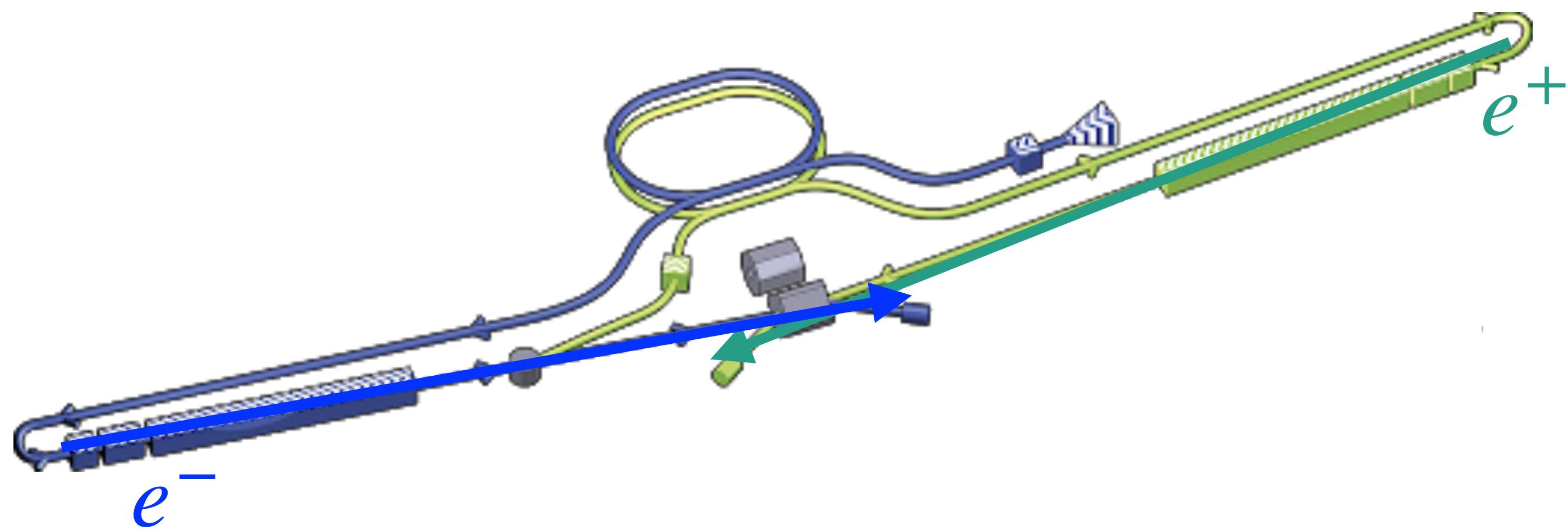
# Introduction

- International Linear Collider (ILC): 高エネルギー電子陽電子ビームを利用した線形加速器実験



# Introduction

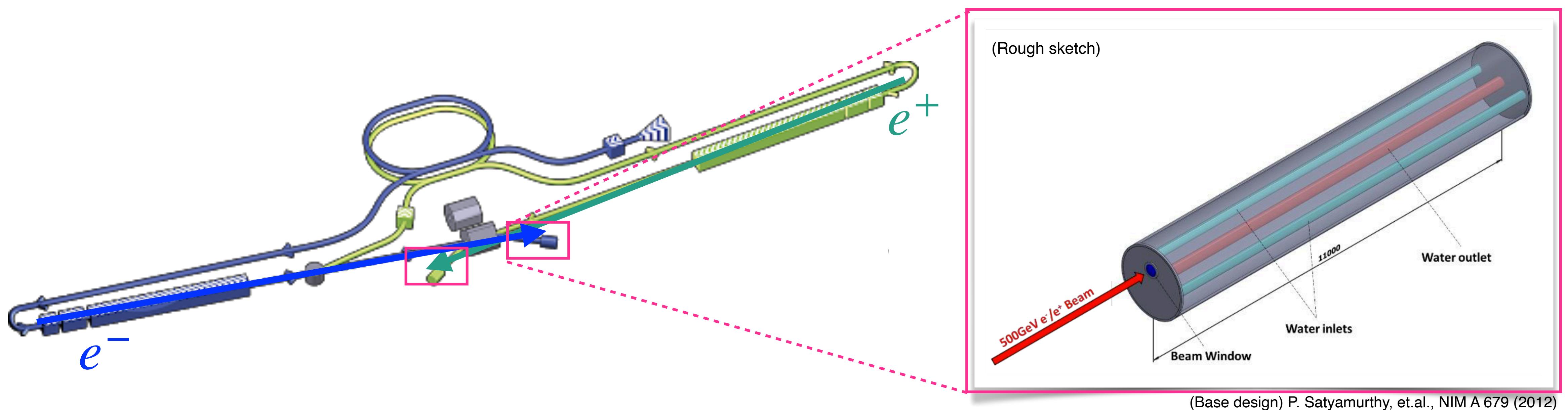
- International Linear Collider (ILC): 高エネルギー電子陽電子ビームを利用した線形加速器実験



- 線形加速器 ⇒ 衝突点を通過したビームは main beam dump で捨てられる

# Introduction

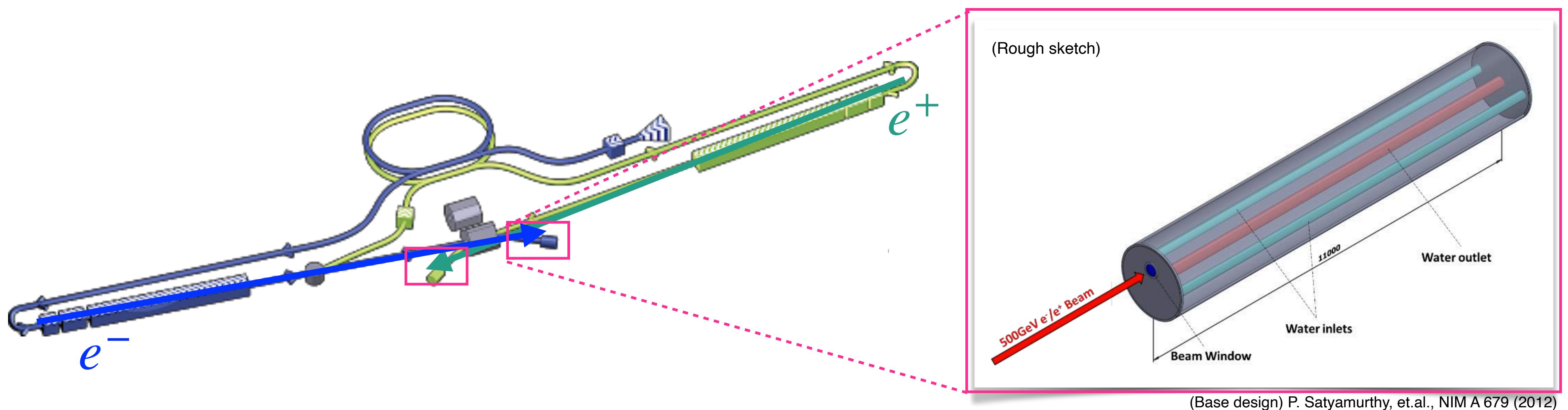
- International Linear Collider (ILC): 高エネルギー電子陽電子ビームを利用した線形加速器実験



- 線形加速器 ⇒ 衝突点を通過したビームは main beam dump で捨てられる

# Introduction

- International Linear Collider (ILC): 高エネルギー電子陽電子ビームを利用した線形加速器実験



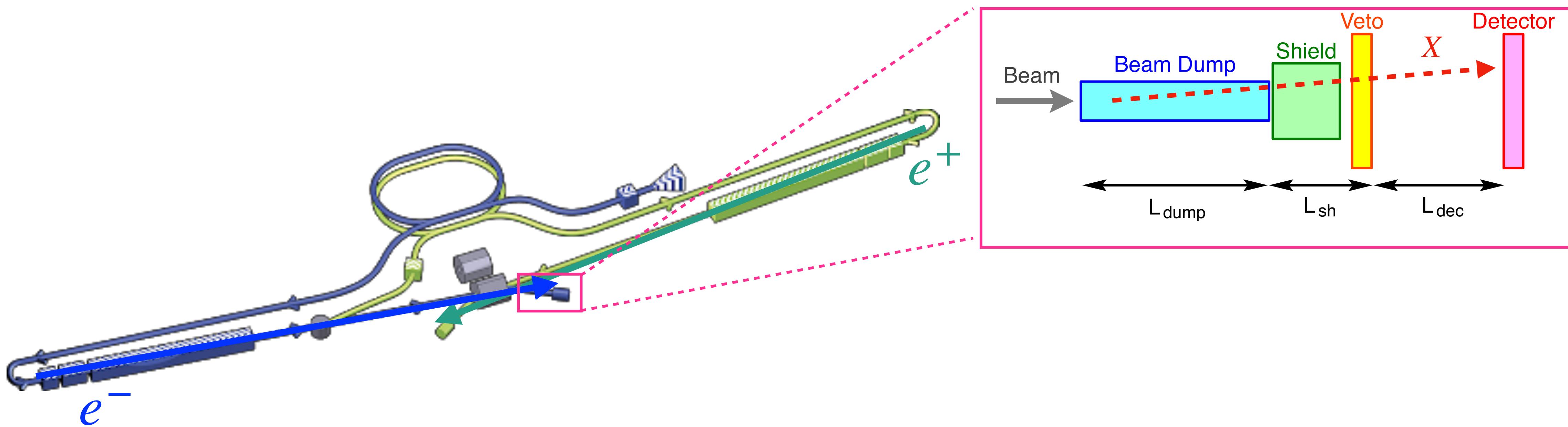
- 線形加速器 ⇒ 衝突点を通過したビームはmain beam dumpで捨てられる

ILC-250 ⇒ 実験室系のエネルギー: 125 GeV, フラックス:  $4 \times 10^{21}$ /year のビーム

捨てられるビームを利用できないか?

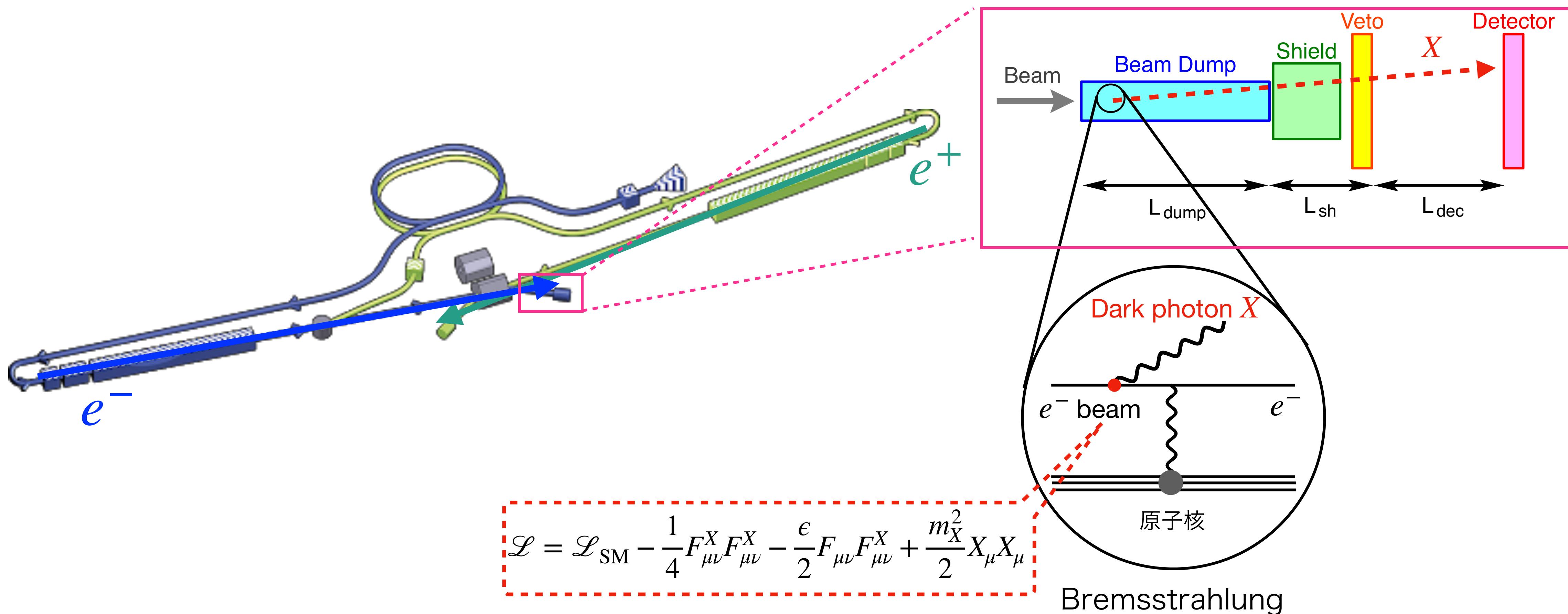
# Introduction

- Beam dumpを利用した長寿命粒子探索実験の提案 [S. Kanemura, T. Moroi, T. Tanabe. arXiv:1507.02809]



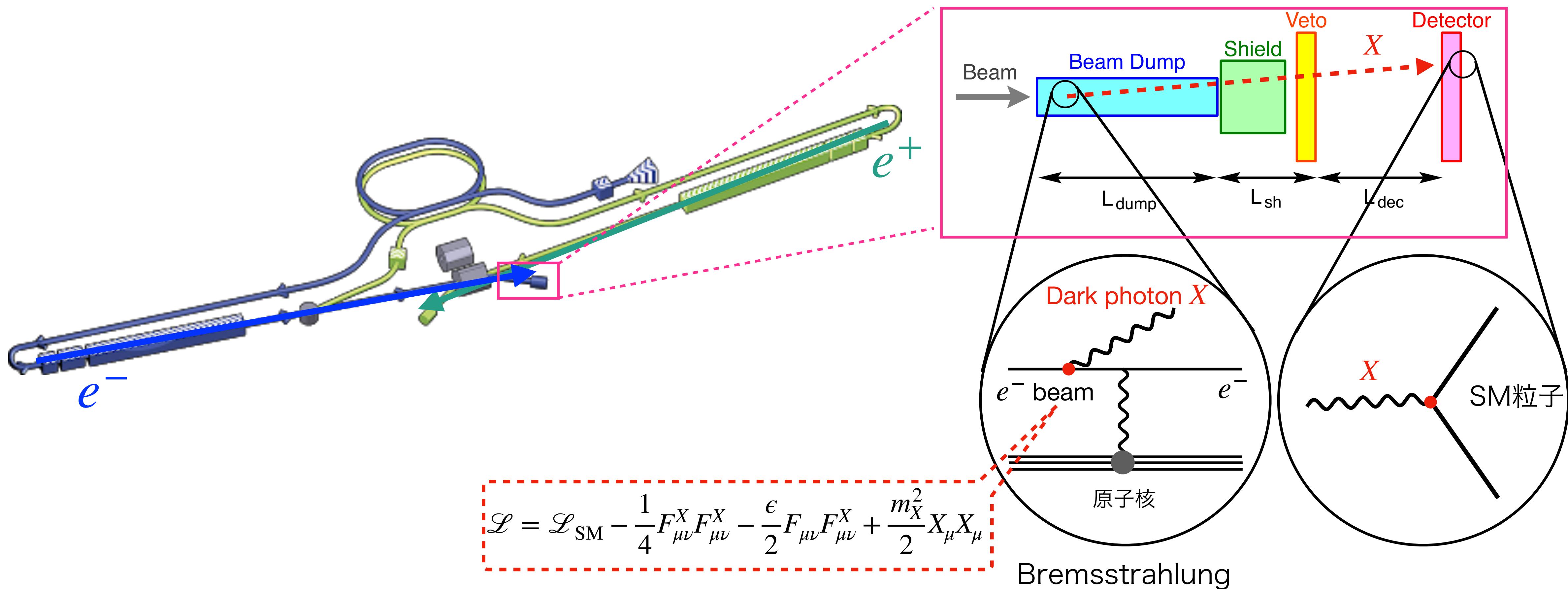
# Introduction

- Beam dumpを利用した長寿命粒子探索実験の提案 [S. Kanemura, T. Moroi, T. Tanabe. arXiv:1507.02809]



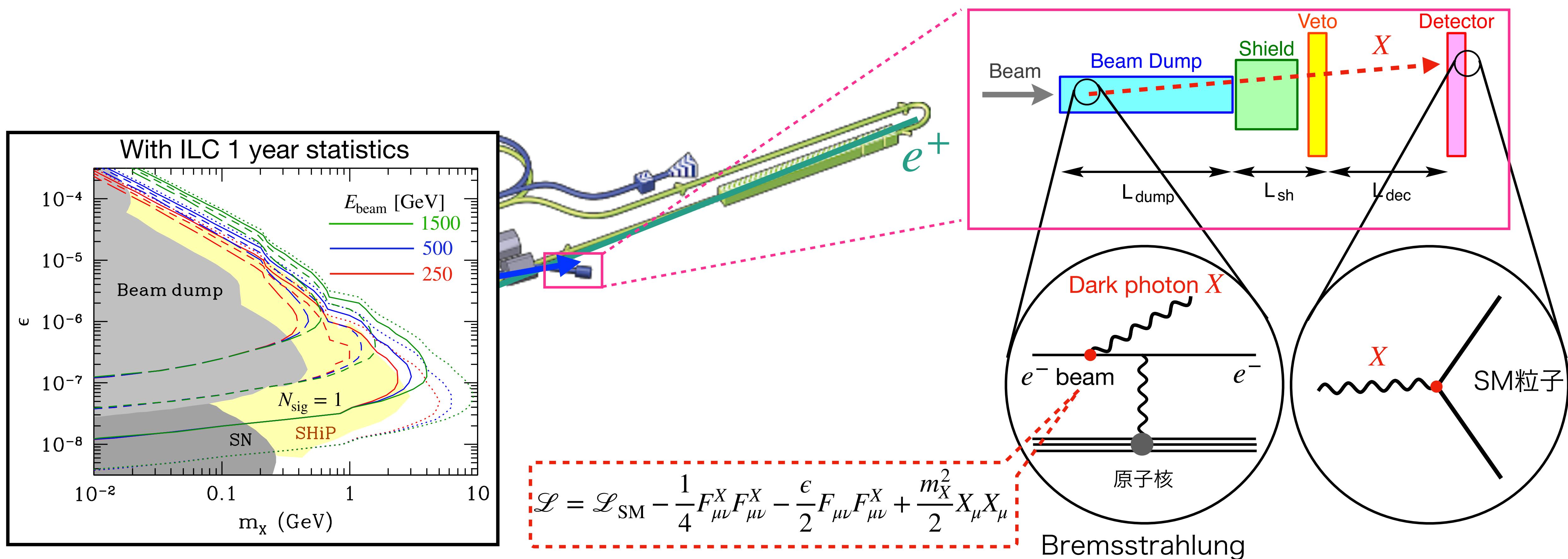
# Introduction

- Beam dumpを利用した長寿命粒子探索実験の提案 [S. Kanemura, T. Moroi, T. Tanabe. arXiv:1507.02809]



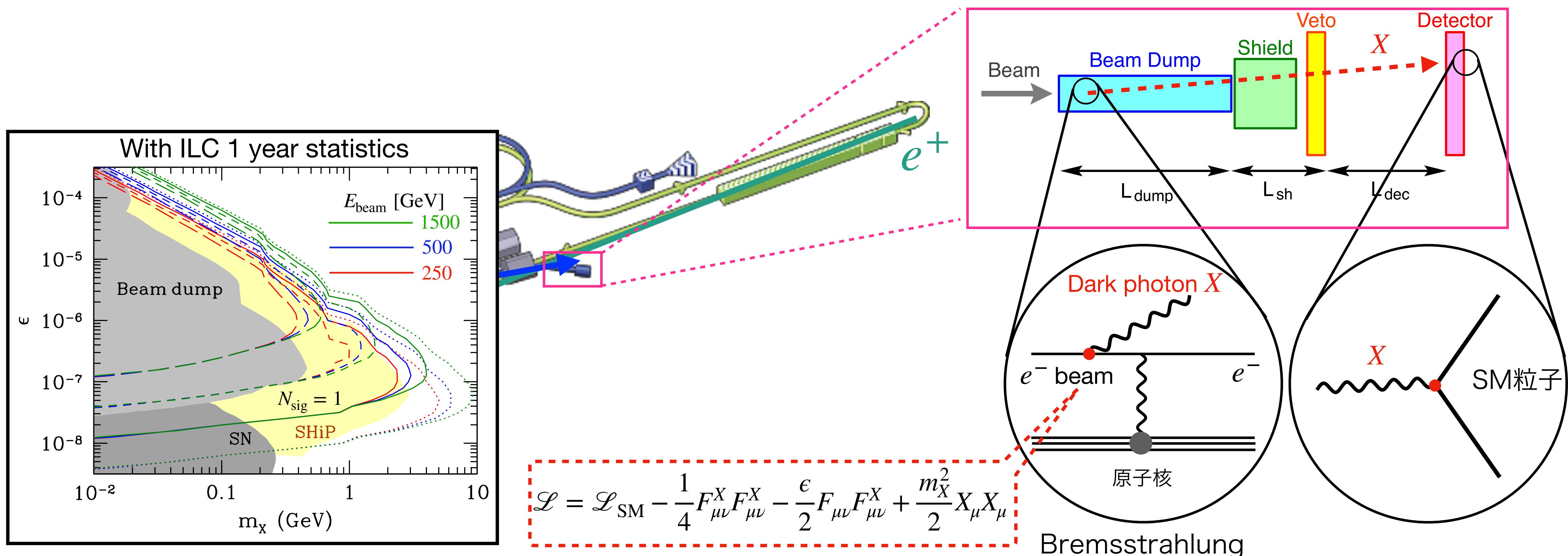
# Introduction

- Beam dumpを利用した長寿命粒子探索実験の提案 [S. Kanemura, T. Moroi, T. Tanabe. arXiv:1507.02809]



# Introduction

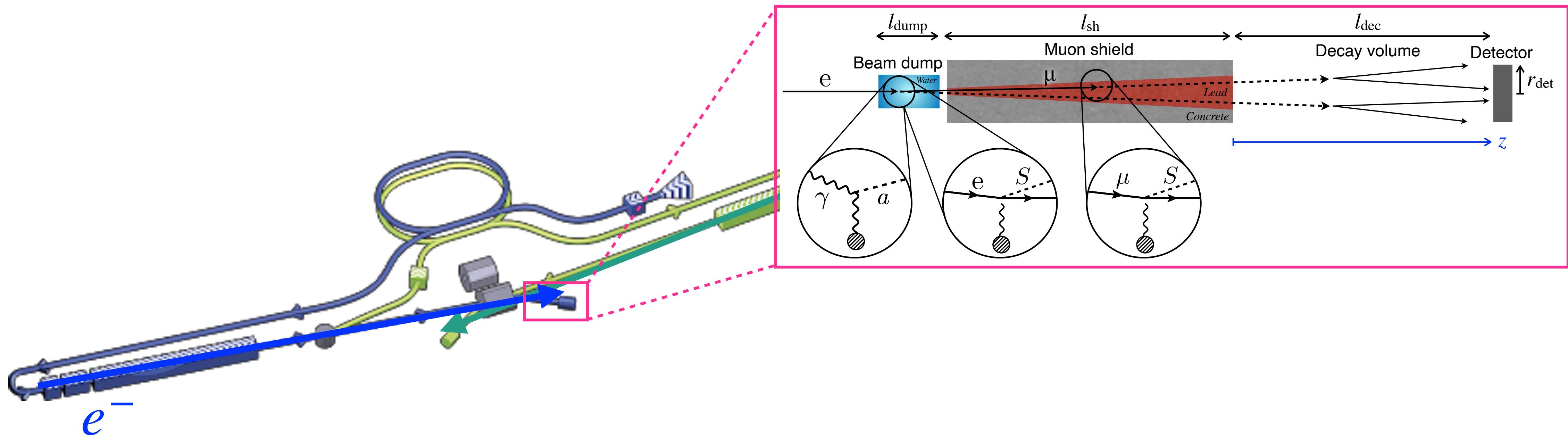
- Beam dumpを利用した長寿命粒子探索実験の提案 [S. Kanemura, T. Moroi, T. Tanabe. arXiv:1507.02809]



ILC beam dump実験は過去のbeam dump実験より高い感度をもつ

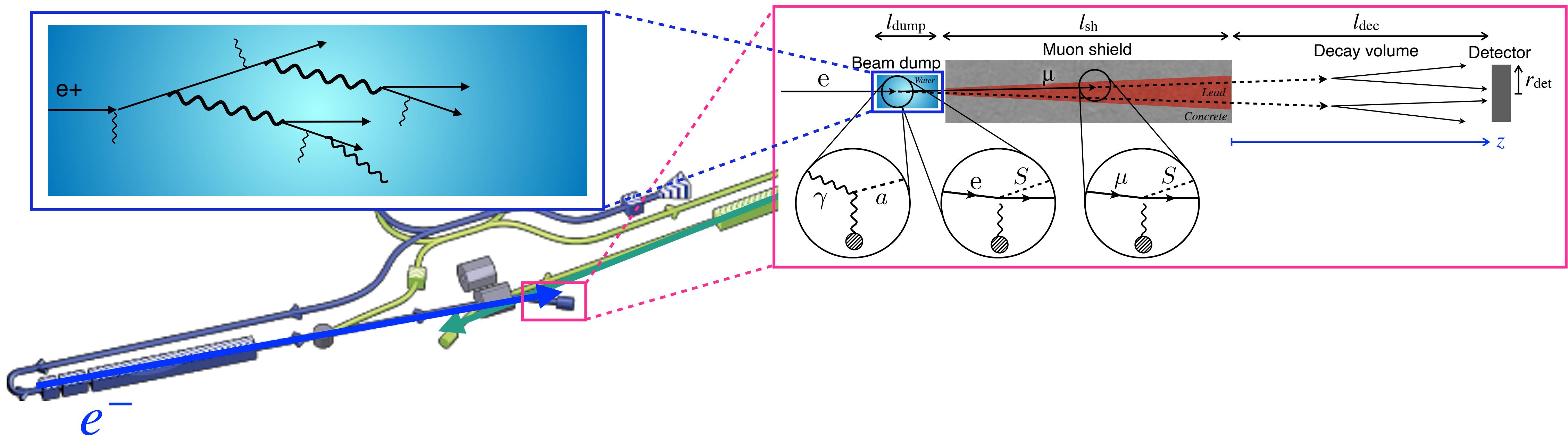
# Introduction

- Beam dumpを利用した長寿命粒子探索実験の提案 [Y. Sakaki, DU. arXiv:2009.13790]



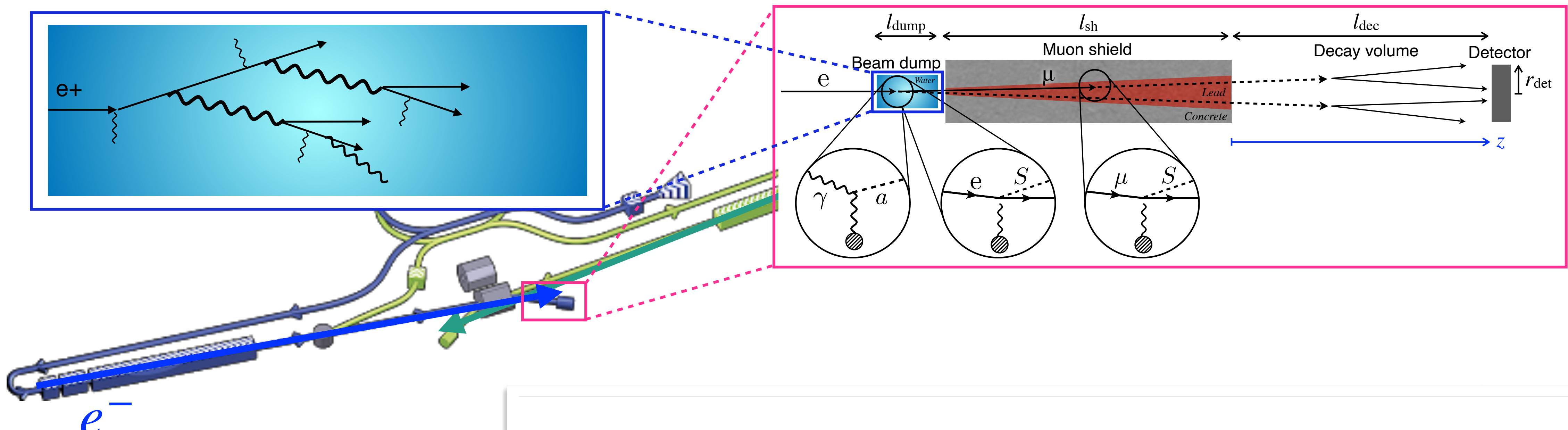
# Introduction

- Beam dumpを利用した長寿命粒子探索実験の提案 [Y. Sakaki, DU. arXiv:2009.13790]



# Introduction

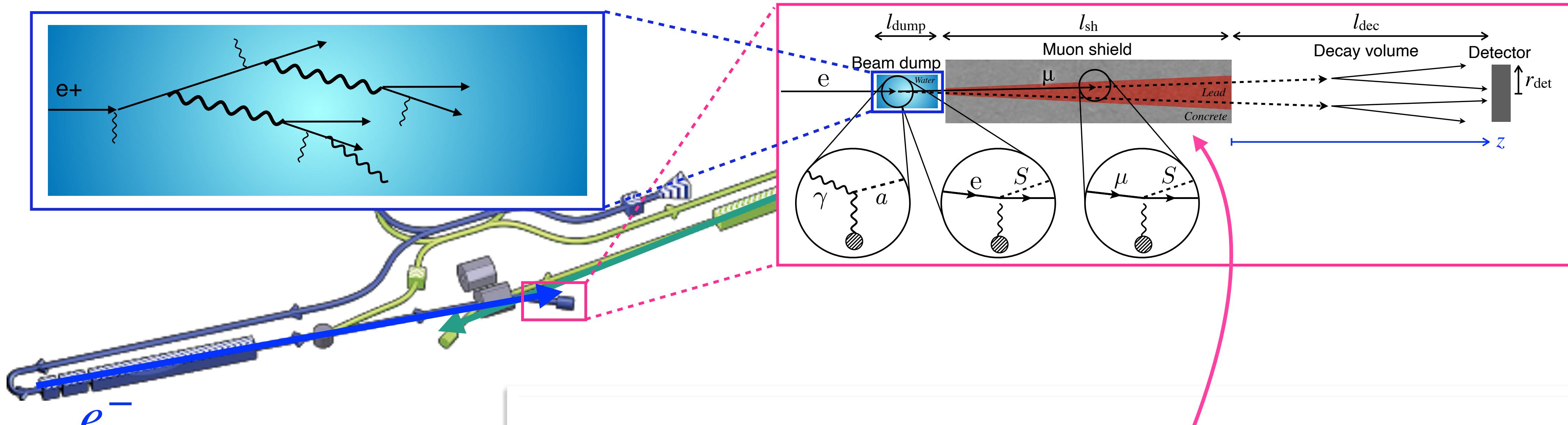
- Beam dumpを利用した長寿命粒子探索実験の提案 [Y. Sakaki, DU. arXiv:2009.13790]



- 電磁シャワーとして生成される光子やmuonなどのsecondary beamの効果に着目

# Introduction

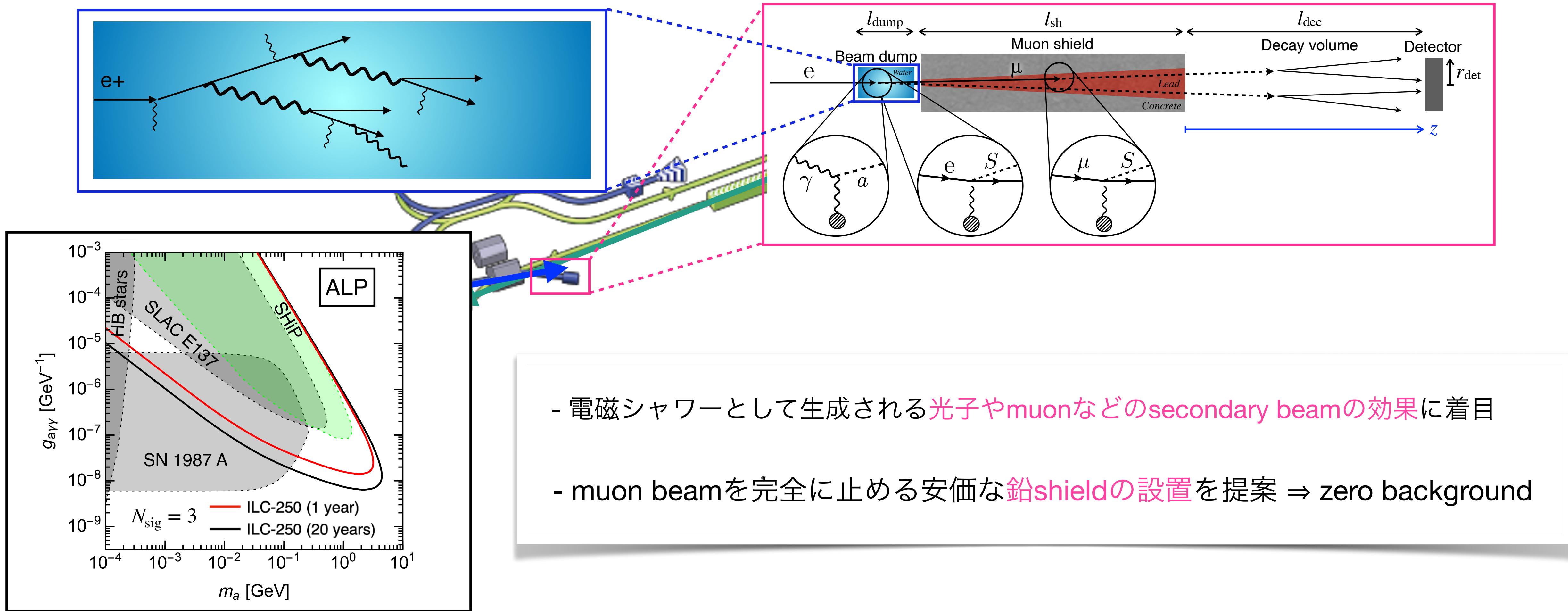
- Beam dumpを利用した長寿命粒子探索実験の提案 [Y. Sakaki, DU. arXiv:2009.13790]



- 電磁シャワーとして生成される光子やmuonなどのsecondary beamの効果に着目
- muon beamを完全に止める安価な鉛shieldの設置を提案 ⇒ zero background

# Introduction

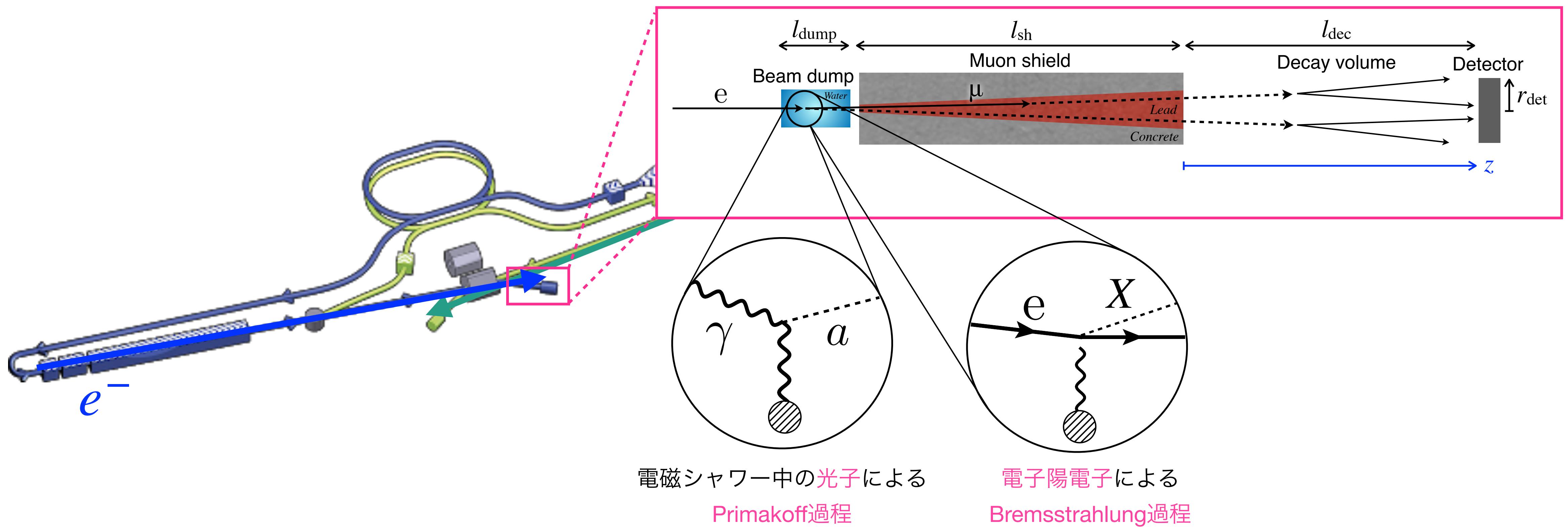
- Beam dumpを利用した長寿命粒子探索実験の提案 [Y. Sakaki, DU. arXiv:2009.13790]



ILC beam dump実験は過去のbeam dumpの感度を超え電磁シャワーの効果は特に重要

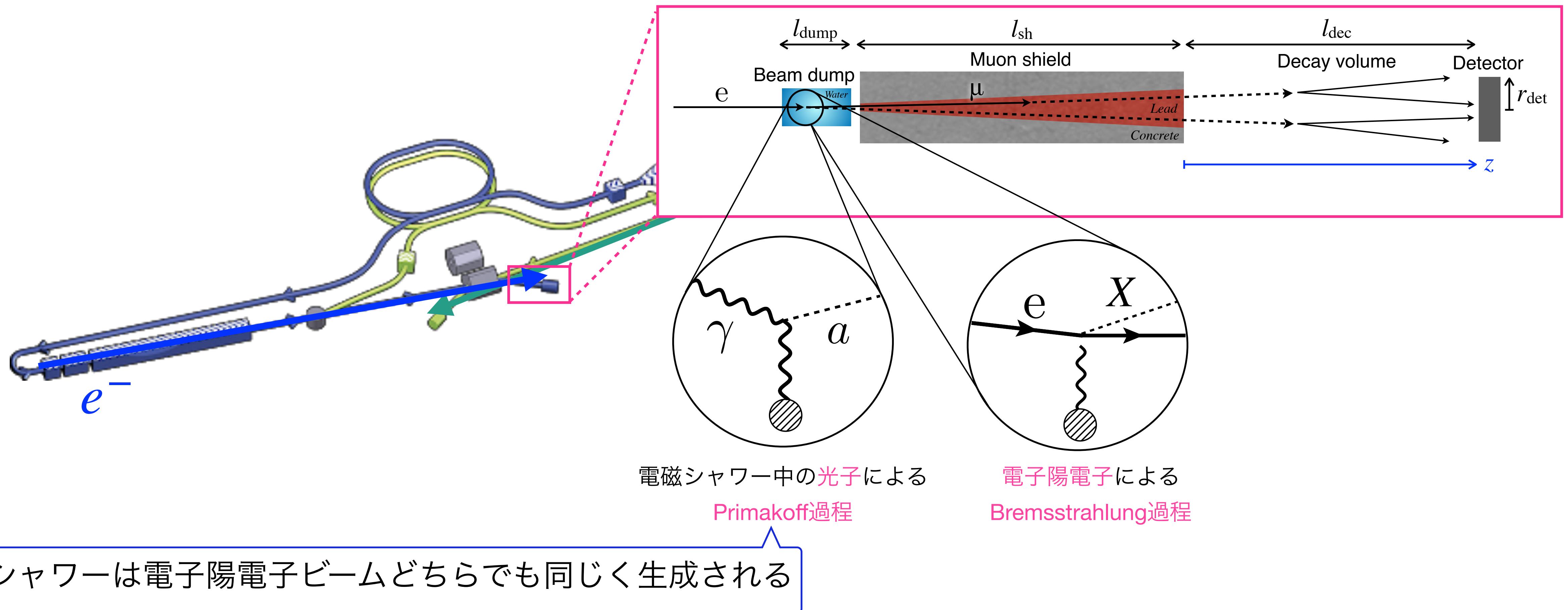
# Introduction

- これらの提案で考えられた新粒子の生成過程



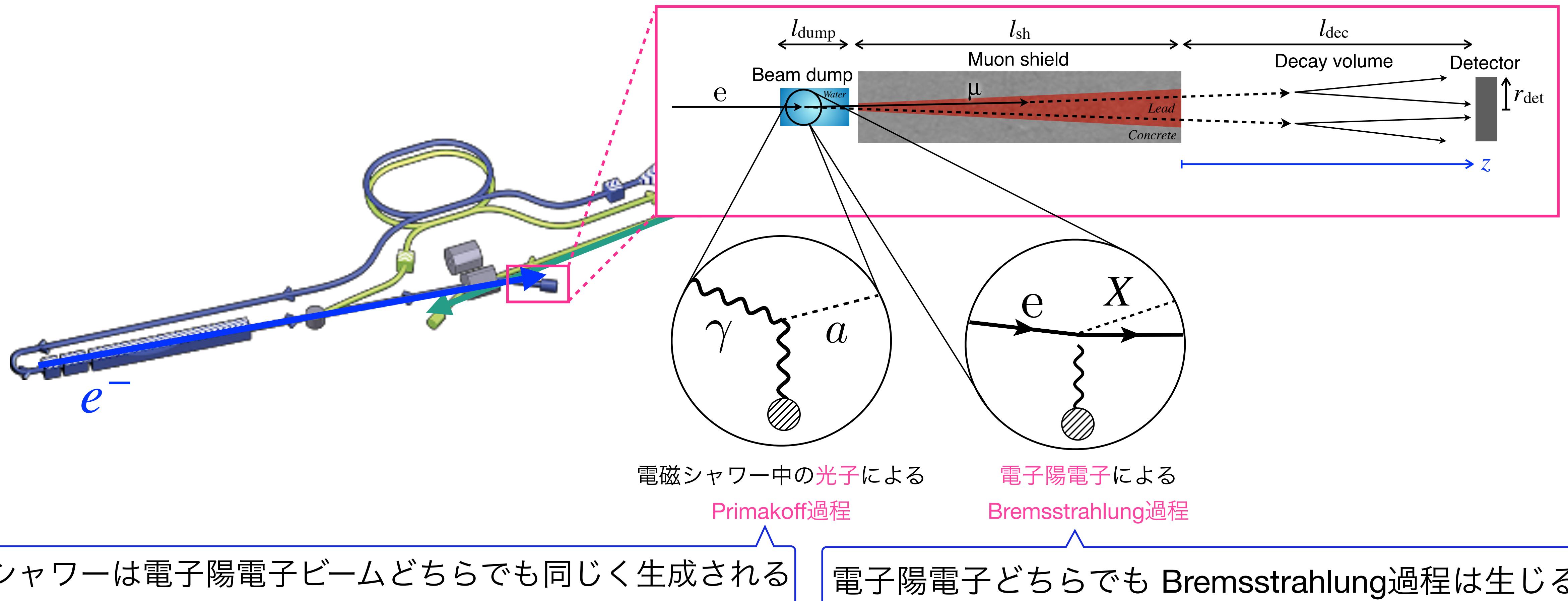
# Introduction

- これらの提案で考えられた新粒子の生成過程



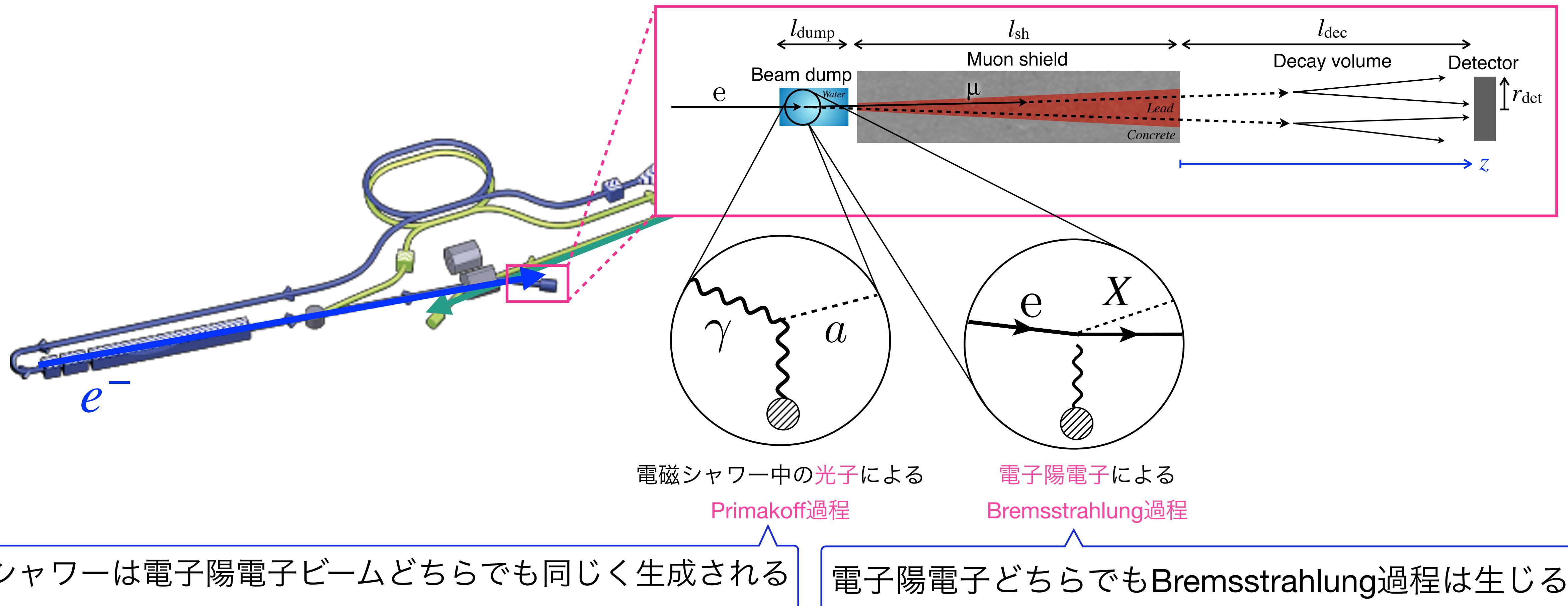
# Introduction

- これらの提案で考えられた新粒子の生成過程



# Introduction

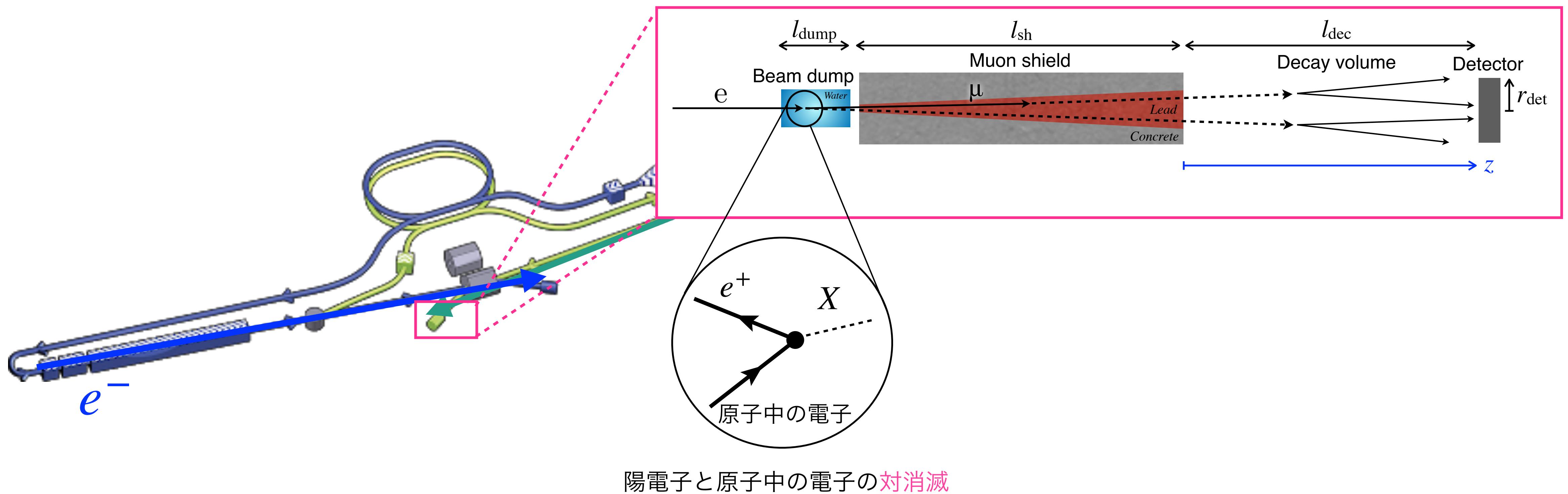
- これらの提案で考えられた新粒子の生成過程



電子陽電子beam dumpで違いが出ない過程が議論されていた

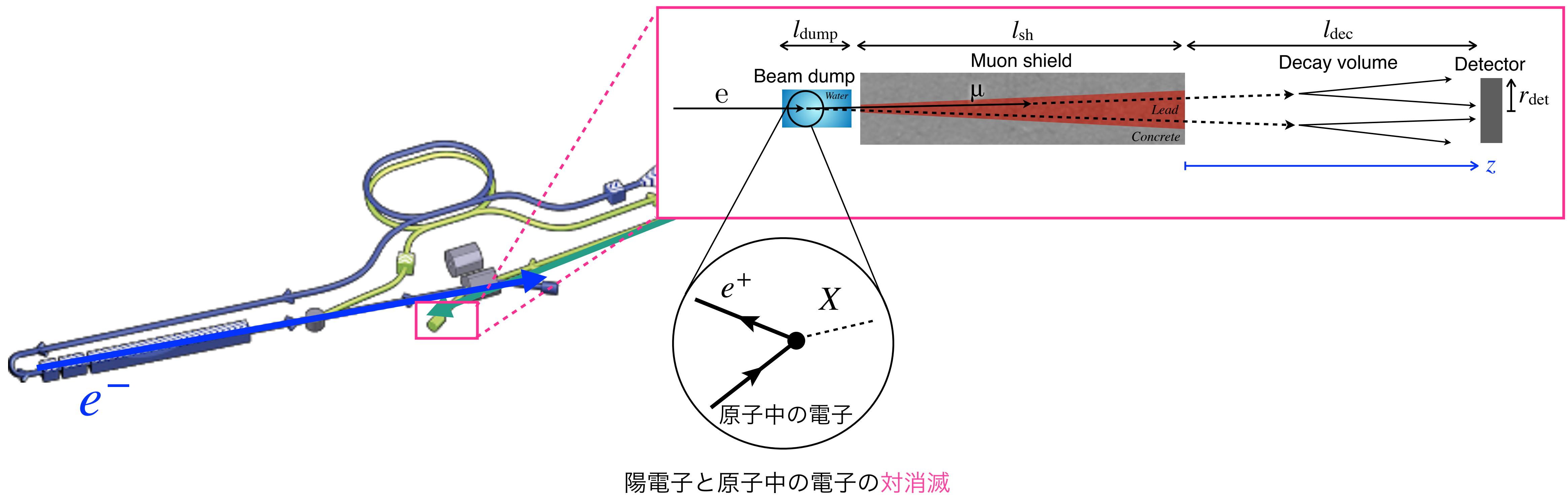
# Introduction

- Primary陽電子ビームはbeam dump中の電子と対消滅できる



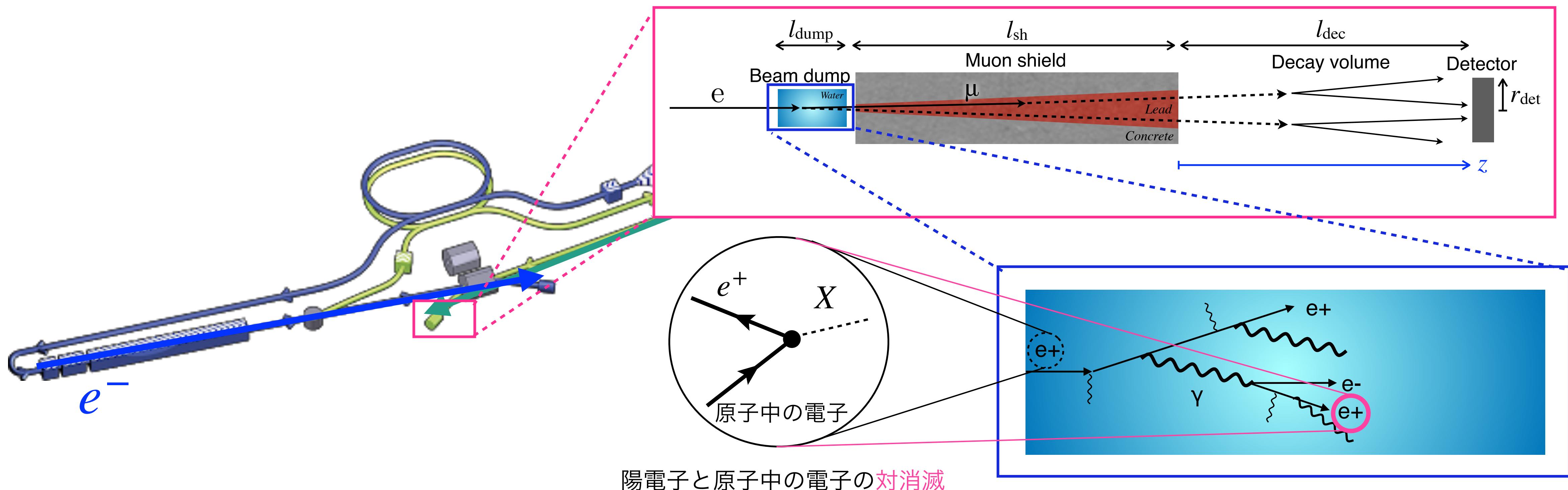
# Introduction

- Primary陽電子ビームはbeam dump中で電子と対消滅できる ⇒ 陽電子ビームが重要になりうる



# Introduction

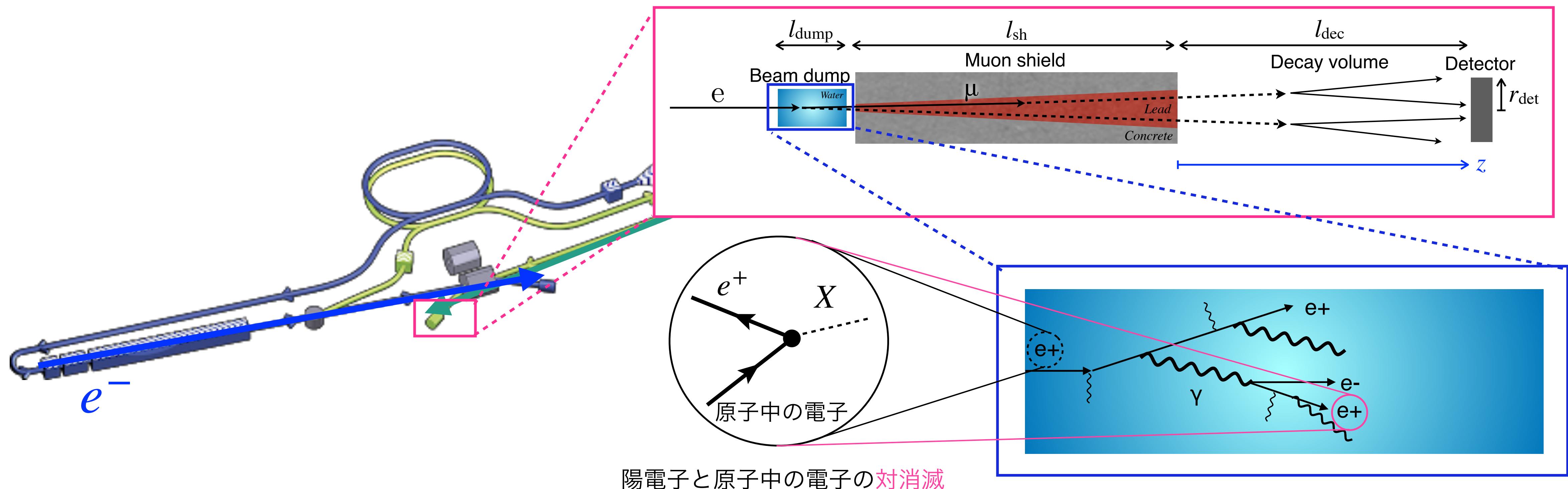
- Primary陽電子ビームはbeam dump中で電子と対消滅できる ⇒ 陽電子ビームが重要になりうる



陽電子はどちらのビームからも電磁シャワーとして生成される

# Introduction

- Primary陽電子ビームはbeam dump中で電子と対消滅できる ⇒ 陽電子ビームが重要になりうる



陽電子はどちらのビームからも電磁シャワーとして生成される

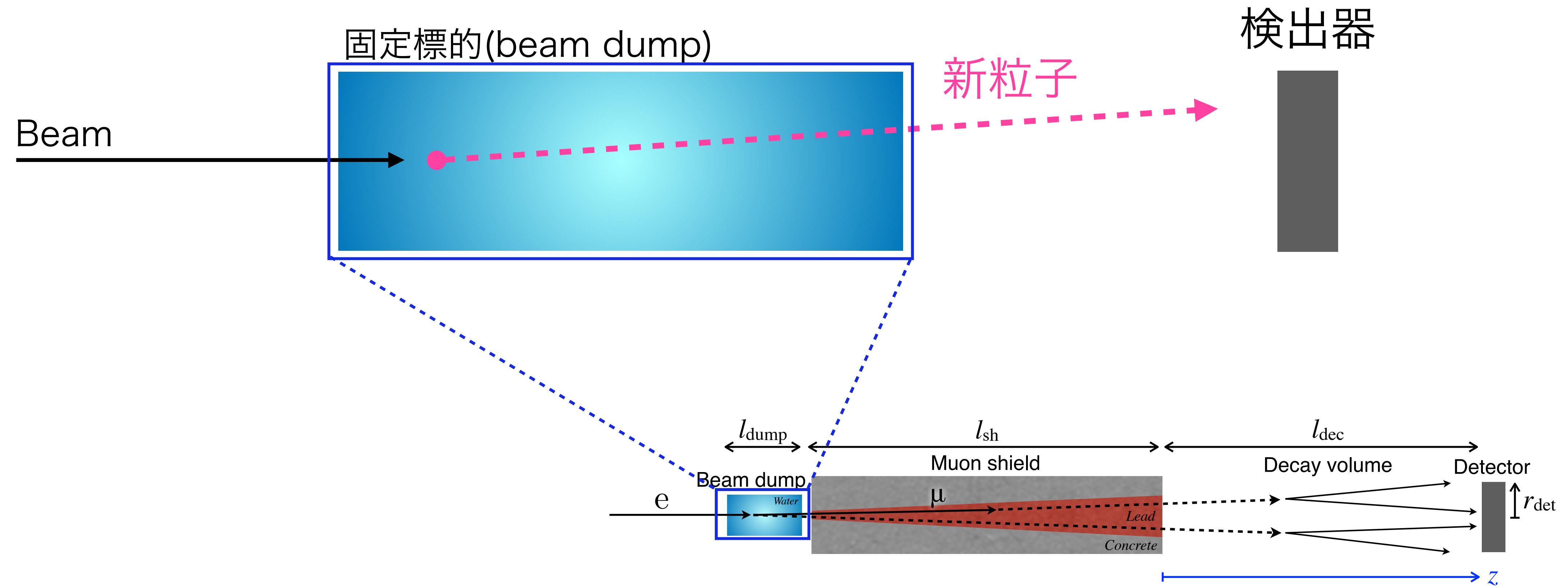
陽電子beam dump実験の感度はどのくらい電子beam dump実験よりいいか?

\* 土木工事にも影響を与える

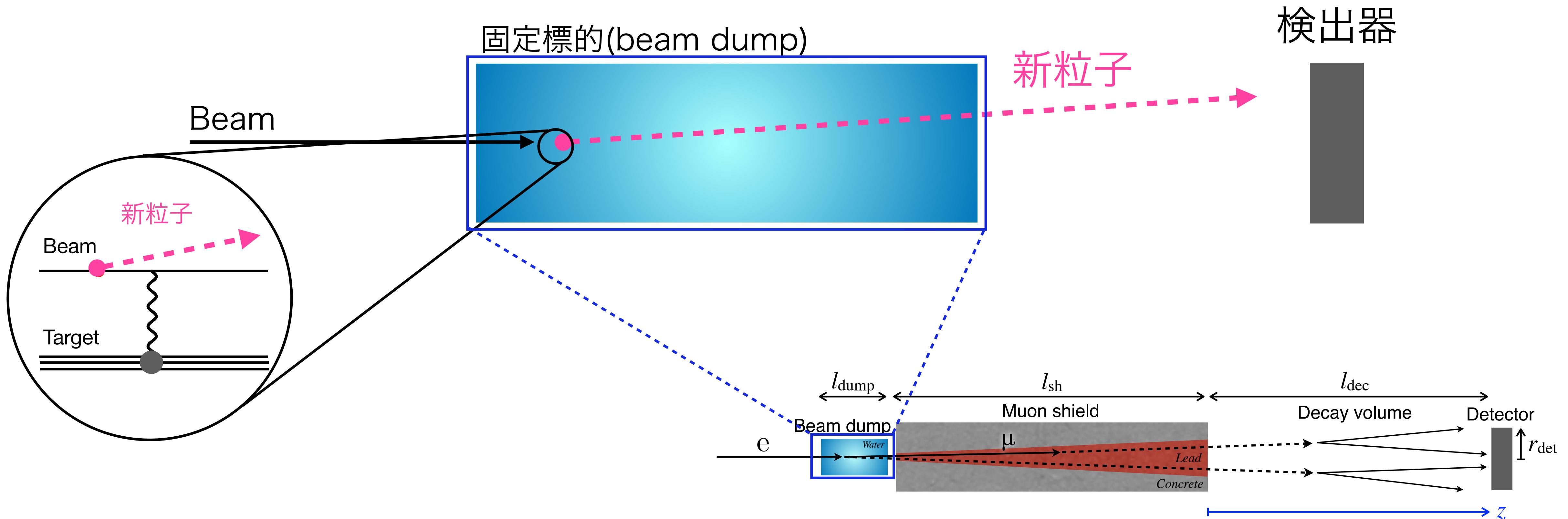
# Outline

- Introduction
- Fixed-Target experimentについて
- ILC main beam dump実験感度の数値計算結果

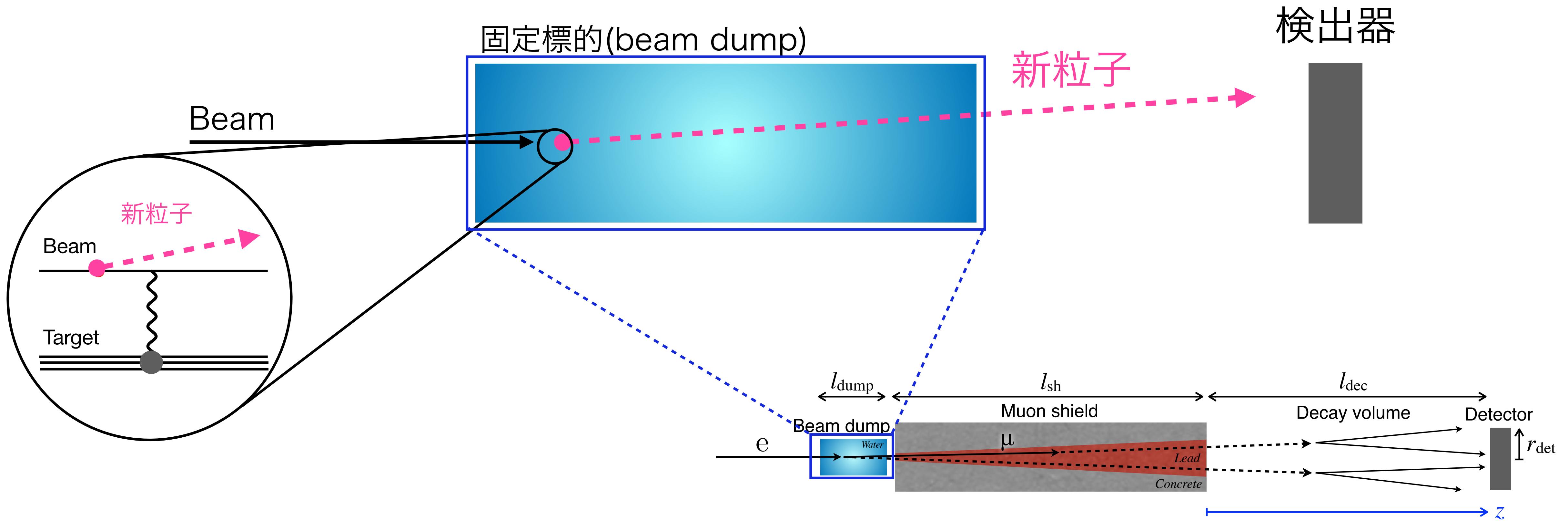
# Fixed target experimentとは



# Fixed target experimentとは

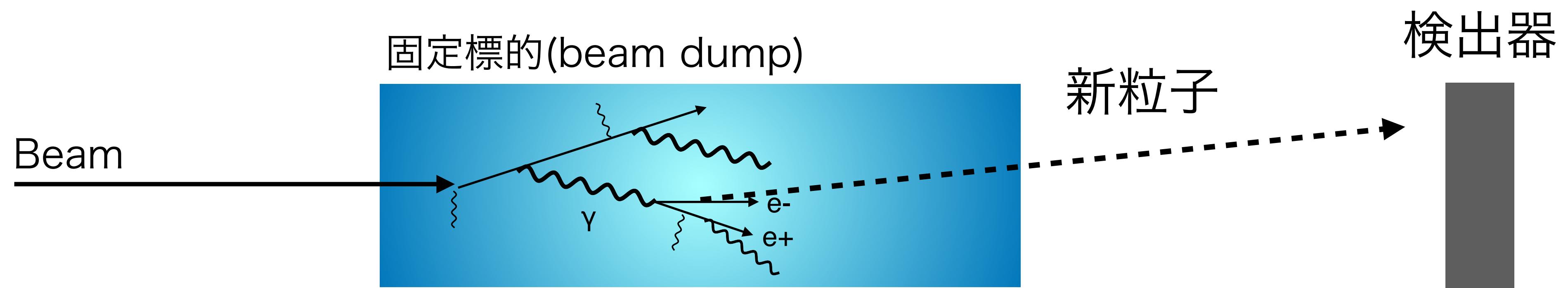


# Fixed target experimentとは



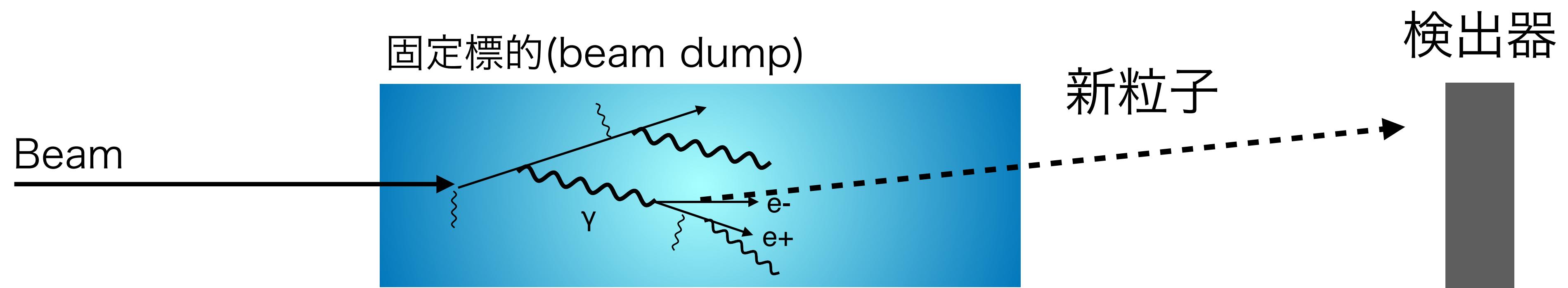
固定標的に電子などのビームをあて、生成された新粒子を検出する実験

# 新粒子の生成数の見積もり方



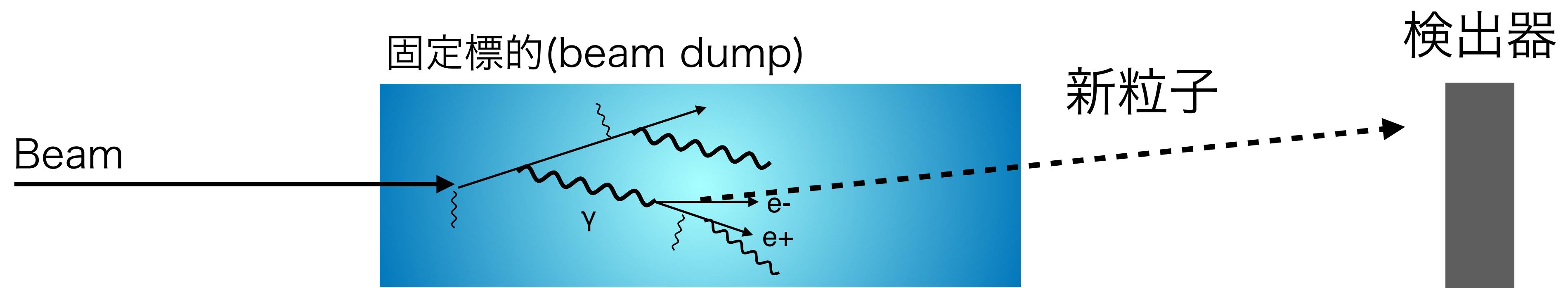
(生成される新粒子の数)

# 新粒子の生成数の見積もり方



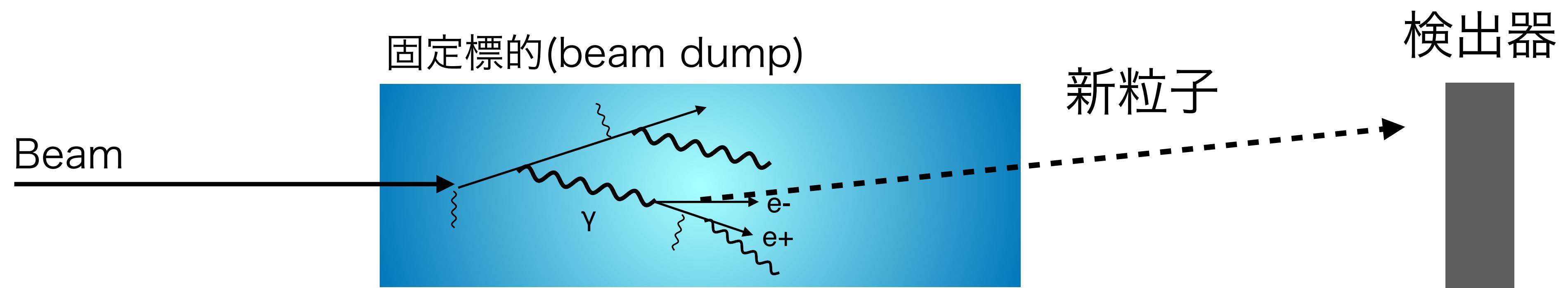
$$(\text{生成される新粒子の数}) = (\text{新粒子の生成断面積}) \times$$

# 新粒子の生成数の見積もり方



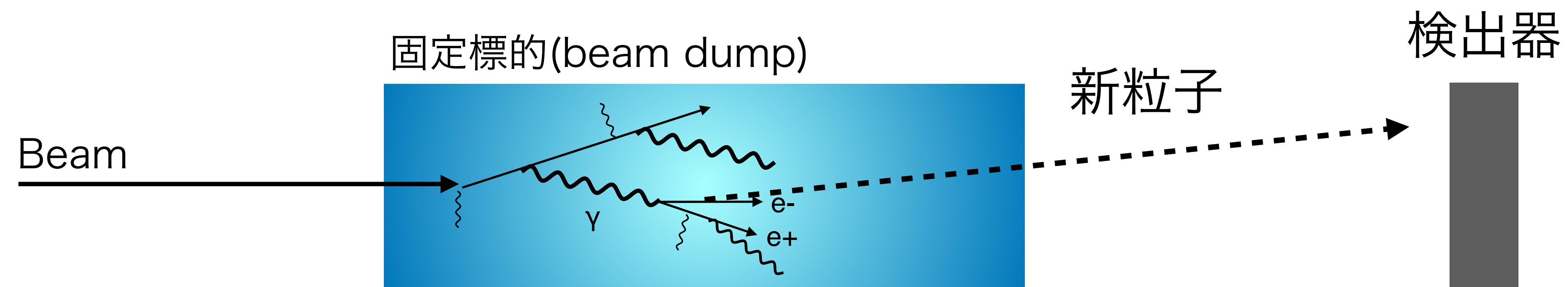
$$(\text{生成される新粒子の数}) = (\text{新粒子の生成断面積}) \times (\text{ビーム粒子の数}) \times$$

# 新粒子の生成数の見積もり方



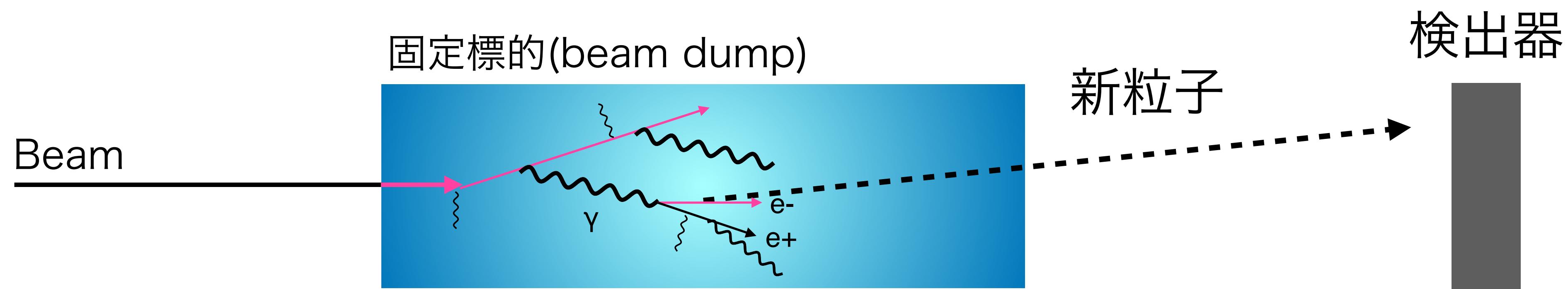
(生成される新粒子の数) = (新粒子の生成断面積) × (ビーム粒子の数) × (Target粒子の数密度) ×

# 新粒子の生成数の見積もり方



$$(\text{生成される新粒子の数}) = (\text{新粒子の生成断面積}) \times (\text{ビーム粒子の数}) \times (\text{Target粒子の数密度}) \times (\text{ビームの経路長})$$

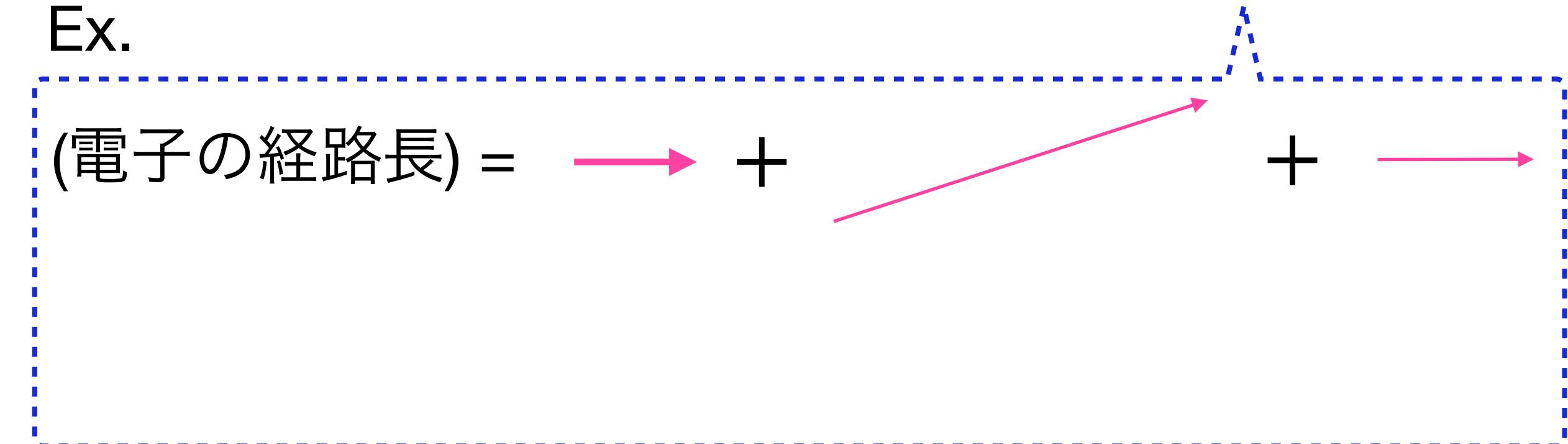
# 新粒子の生成数の見積もり方



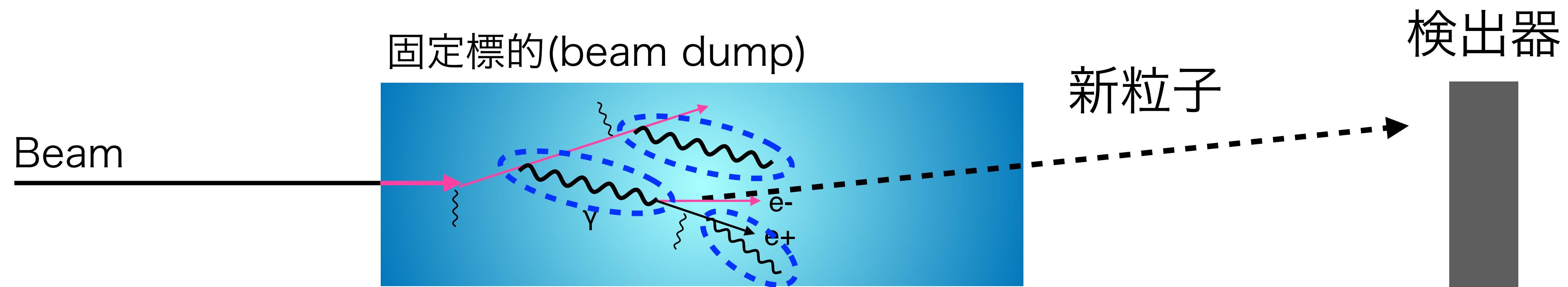
(生成される新粒子の数) = (新粒子の生成断面積) × (ビーム粒子の数) × (Target粒子の数密度) × (ビームの経路長)

Ex.

$$(電子の経路長) = \rightarrow + + \rightarrow$$



# 新粒子の生成数の見積もり方



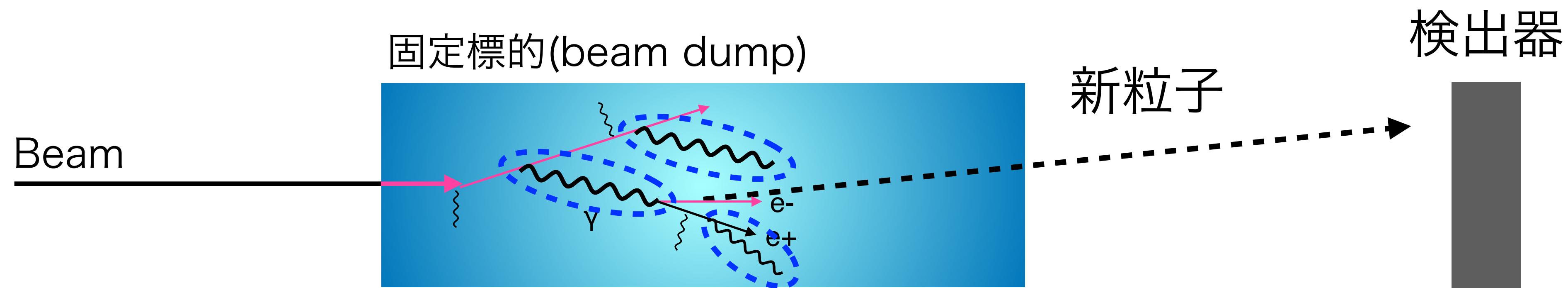
(生成される新粒子の数) = (ビーム粒子の数) × (Target粒子の数密度) × (ビームの経路長) × (新粒子の生成断面積)

Ex.

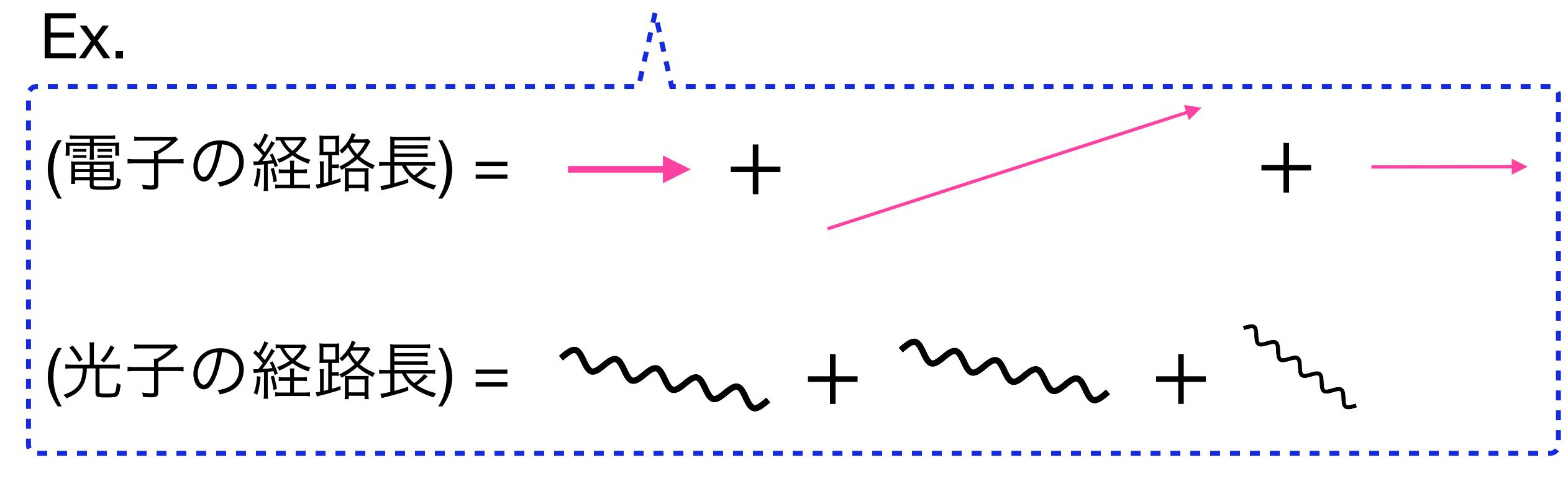
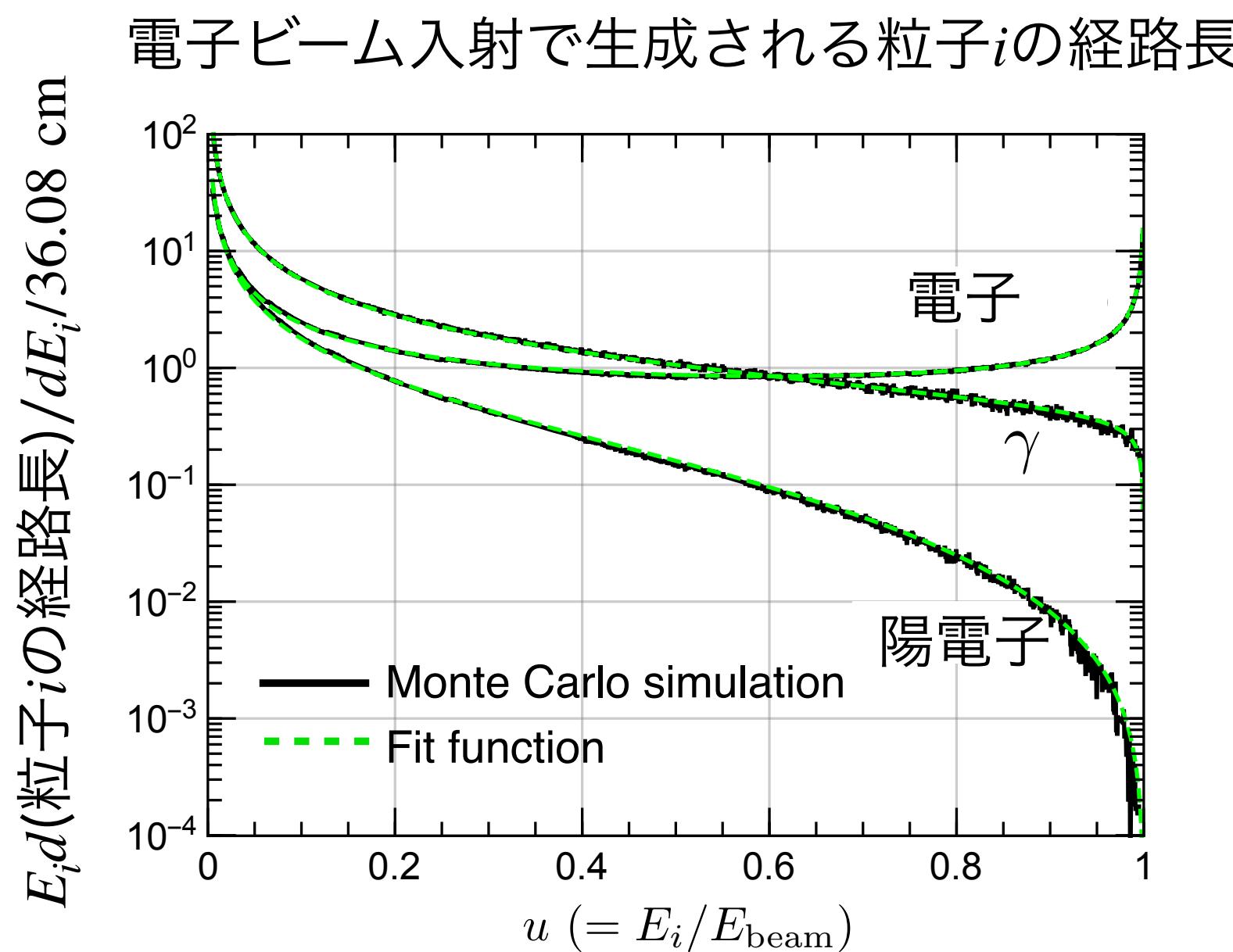
$$(\text{電子の経路長}) = \rightarrow + \rightarrow +$$

$$(\text{光子の経路長}) = \sim + \sim + \sim$$

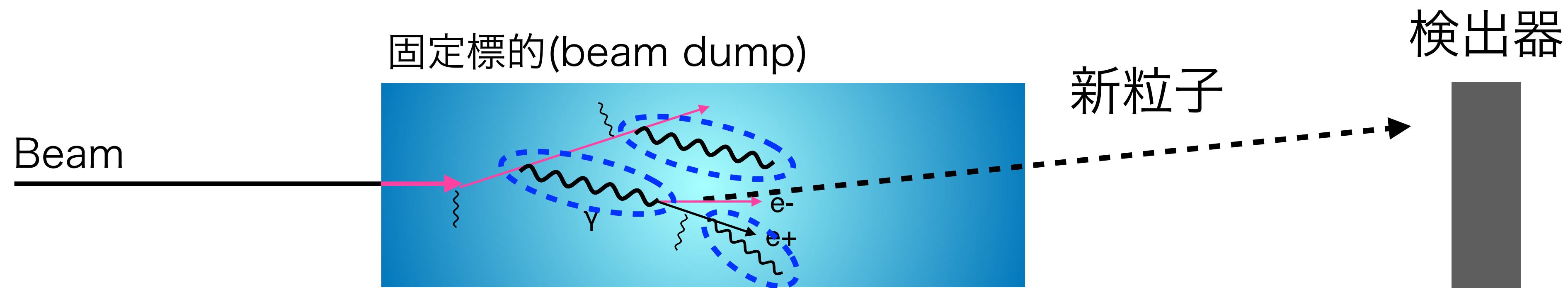
# 新粒子の生成数の見積もり方



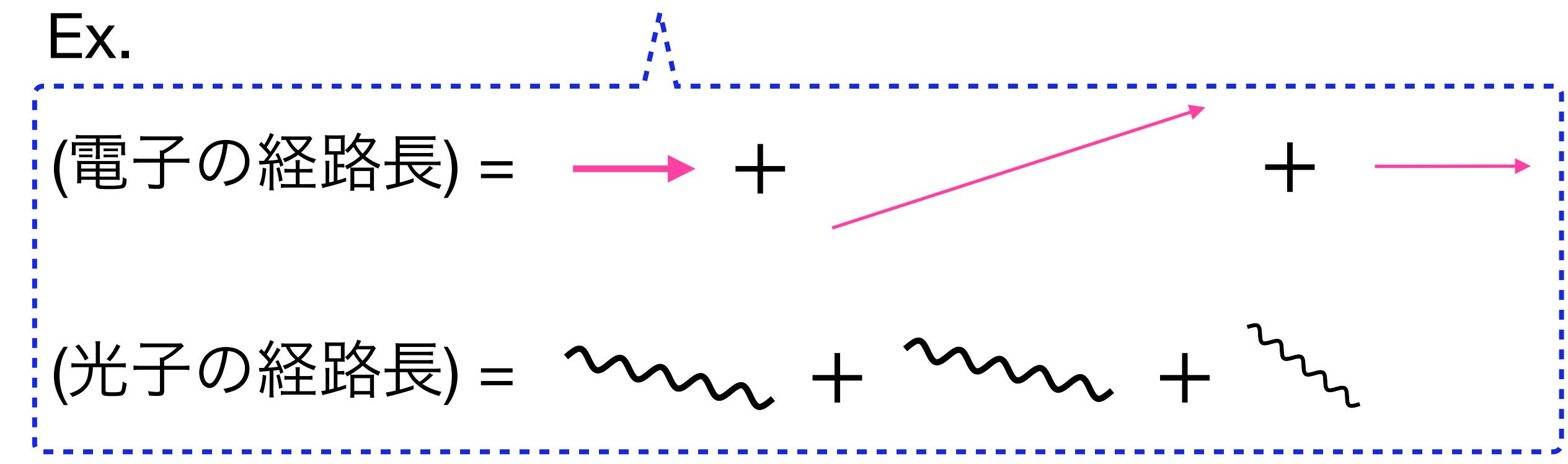
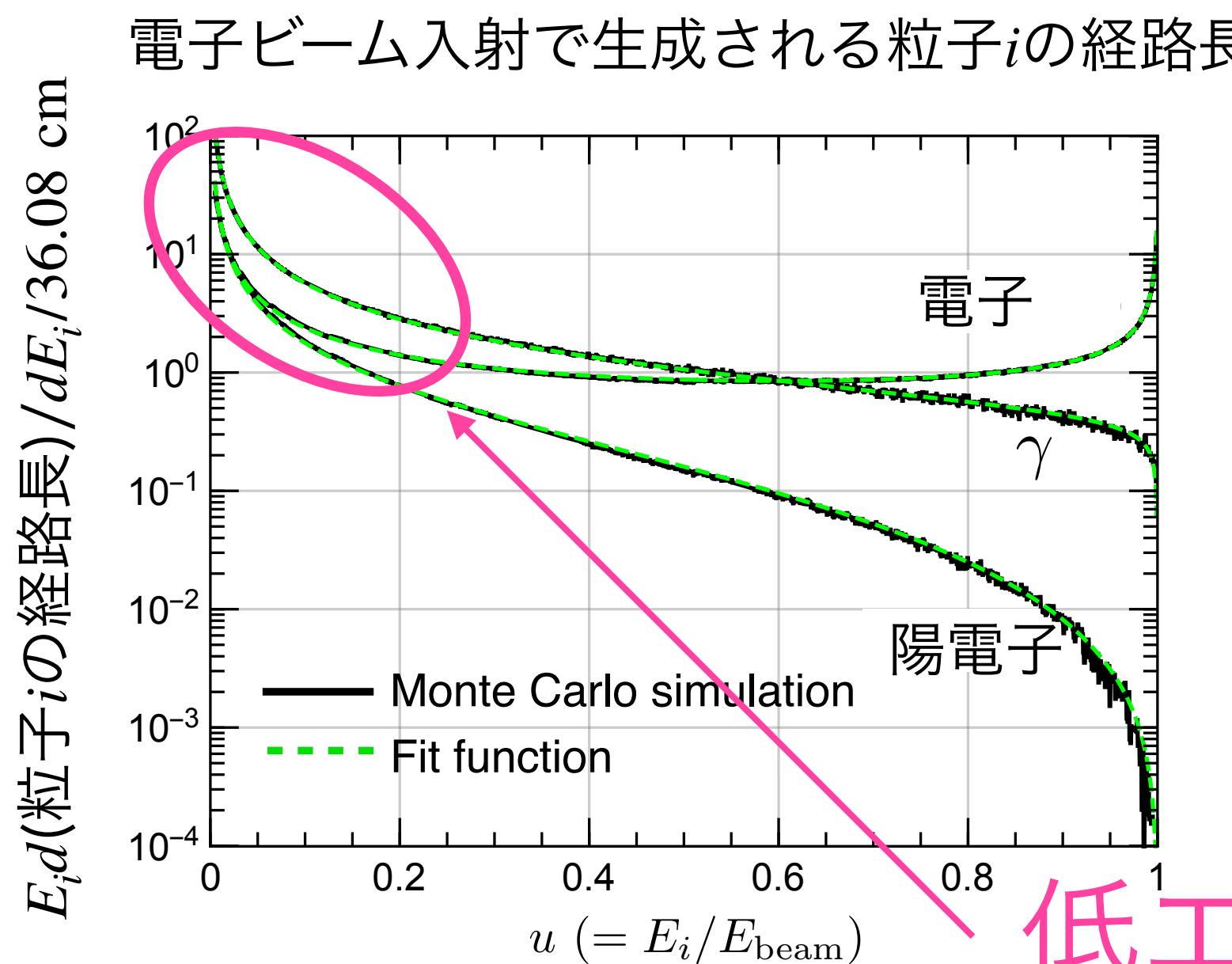
$$(\text{生成される新粒子の数}) = (\text{ビーム粒子の数}) \times (\text{Target粒子の数密度}) \times (\text{ビームの経路長}) \times (\text{新粒子の生成断面積})$$



# 新粒子の生成数の見積もり方

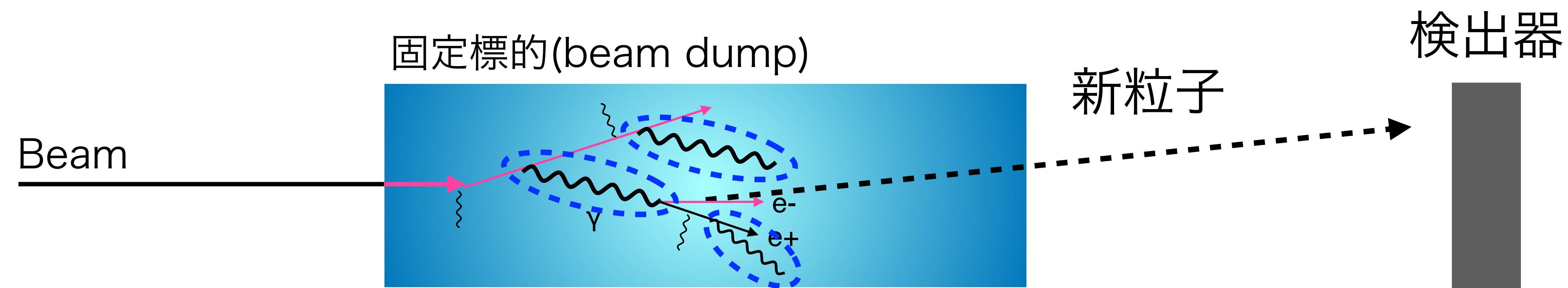


$$(\text{生成される新粒子の数}) = (\text{ビーム粒子の数}) \times (\text{Target粒子の数密度}) \times (\text{ビームの経路長}) \times (\text{新粒子の生成断面積})$$



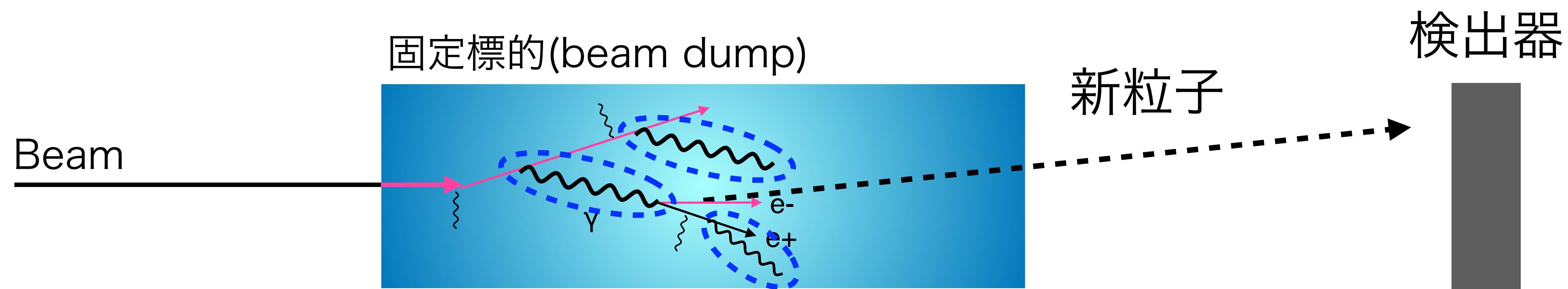
低エネルギーの電磁シャワーが沢山生成される

# 新粒子の生成数の見積もり方



$$(\text{生成される新粒子の数}) = (\text{ビーム粒子の数}) \times (\text{Target粒子の数密度}) \times (\text{ビームの経路長}) \times (\text{新粒子の生成断面積})$$

# 新粒子の生成数の見積もり方

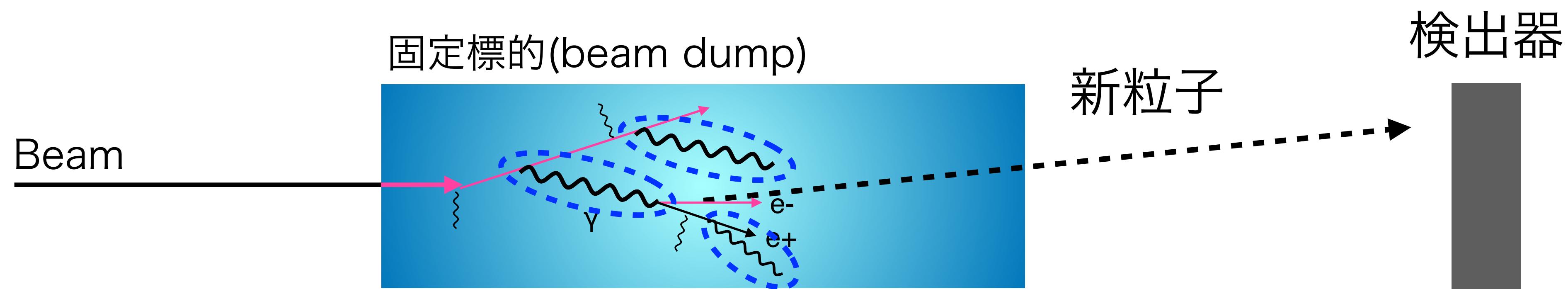


$$\text{(生成される新粒子の数)} = \boxed{\text{(ビーム粒子の数)} \times \text{(Target粒子の数密度)} \times \text{(ビームの経路長)} \times \text{(新粒子の生成断面積)}}$$

||

(ルミノシティ)

# 新粒子の生成数の見積もり方



$4 \times 10^{21} / \text{year} @ \text{ILC}$

$\sim 10^{23} \text{ cm}^{-3}$

$\sim 10^3 \text{ cm}$

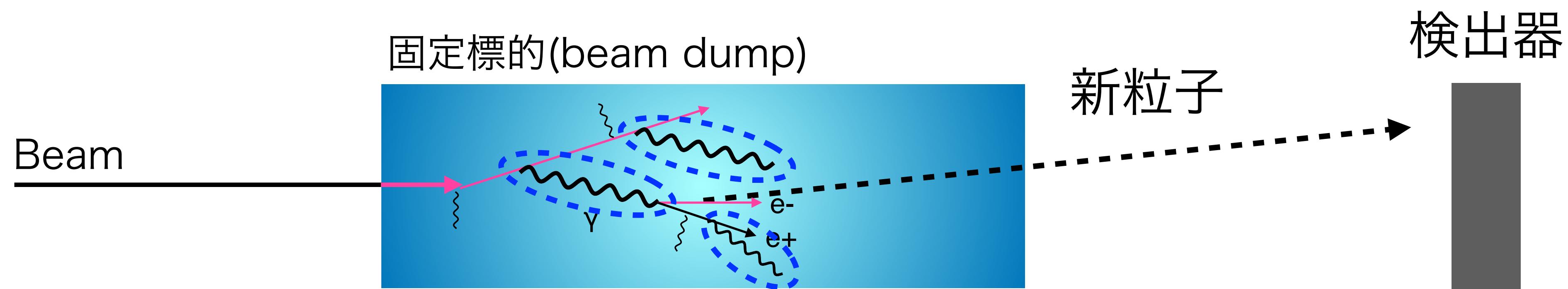
(生成される新粒子の数) = [(ビーム粒子の数) × (Target粒子の数密度) × (ビームの経路長) × (新粒子の生成断面積)]

||

(ルミノシティ)  $\sim 10^8 \text{ fb}^{-1} / \text{year} @ \text{ILC}$

※  $\text{fb}^{-1} = 10^{39} \text{ cm}^{-2}$

# 新粒子の生成数の見積もり方



$4 \times 10^{21} / \text{year} @ \text{ILC}$

$\sim 10^{23} \text{ cm}^{-3}$

$\sim 10^3 \text{ cm}$

(生成される新粒子の数) = [(ビーム粒子の数) × (Target粒子の数密度) × (ビームの経路長) × (新粒子の生成断面積)]

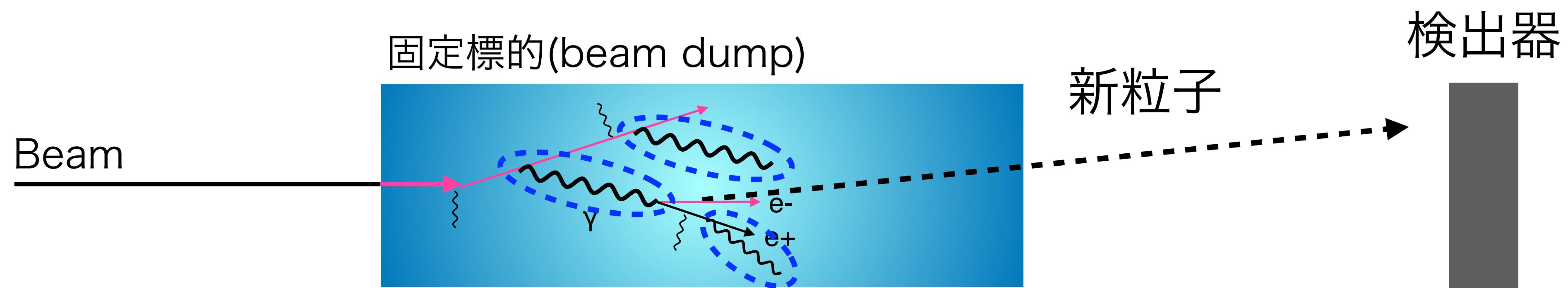
||

(ルミノシティ)  $\sim 10^8 \text{ fb}^{-1} / \text{year} @ \text{ILC}$

※  $\text{fb}^{-1} = 10^{39} \text{ cm}^{-2}$

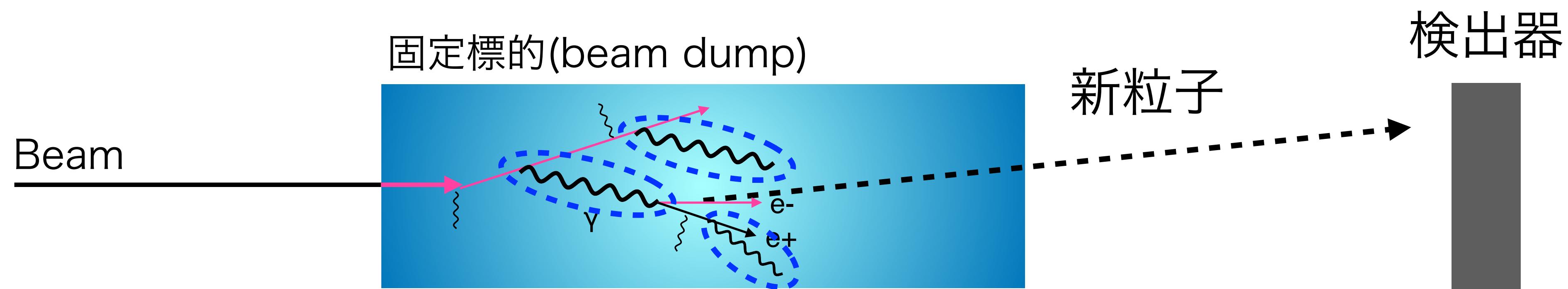
高いルミノシティ  $\Rightarrow$  SMとの結合定数の小さな理論に感度のある実験

# 新粒子の生成数の見積もり方

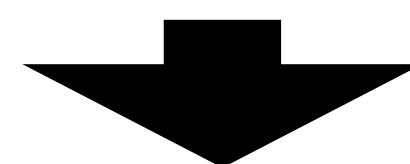


$$(\text{生成される新粒子の数}) = (\text{ルミノシティ}) \times (\text{新粒子の生成断面積})$$

# 新粒子の生成数の見積もり方



(生成される新粒子の数) = (ルミノシティ) × (新粒子の生成断面積)



生成された新粒子全てが検出できるわけではない

(新粒子イベントの数) = (ルミノシティ) × (新粒子の生成断面積) × (アクセプタンス)

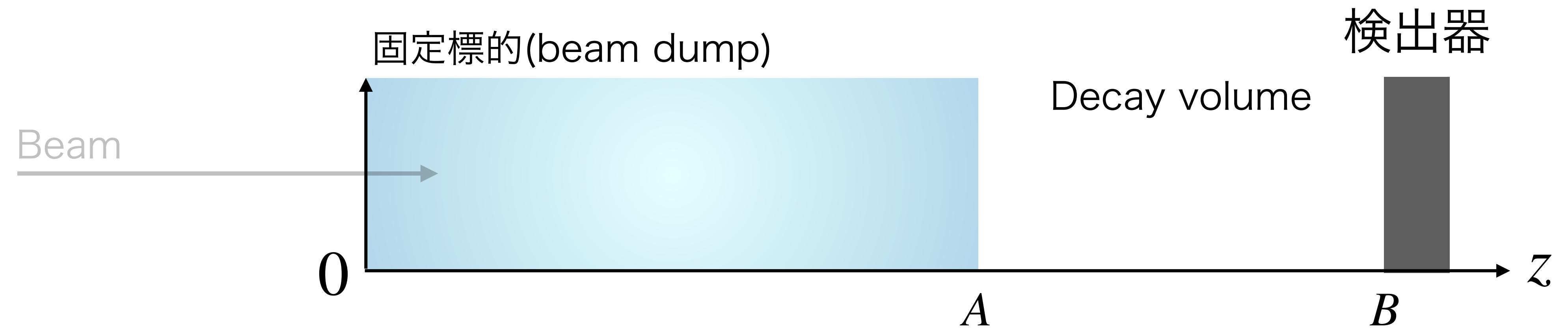
# アクセプタンス (1)

- 生成された新粒子が固定標的中で崩壊すると、検出器で新粒子の効果が見えない



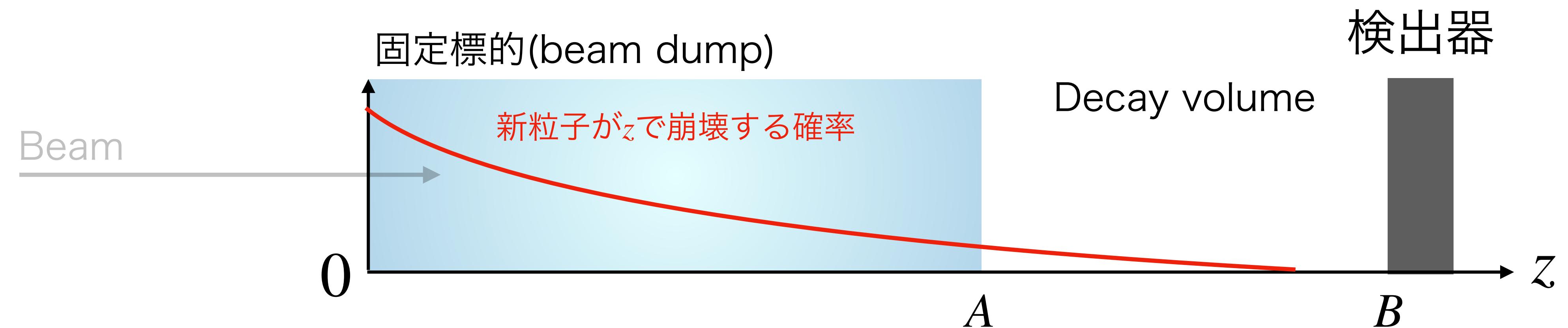
# アクセプタンス (1)

- 生成された新粒子が固定標的中で崩壊すると、検出器で新粒子の効果が見えない



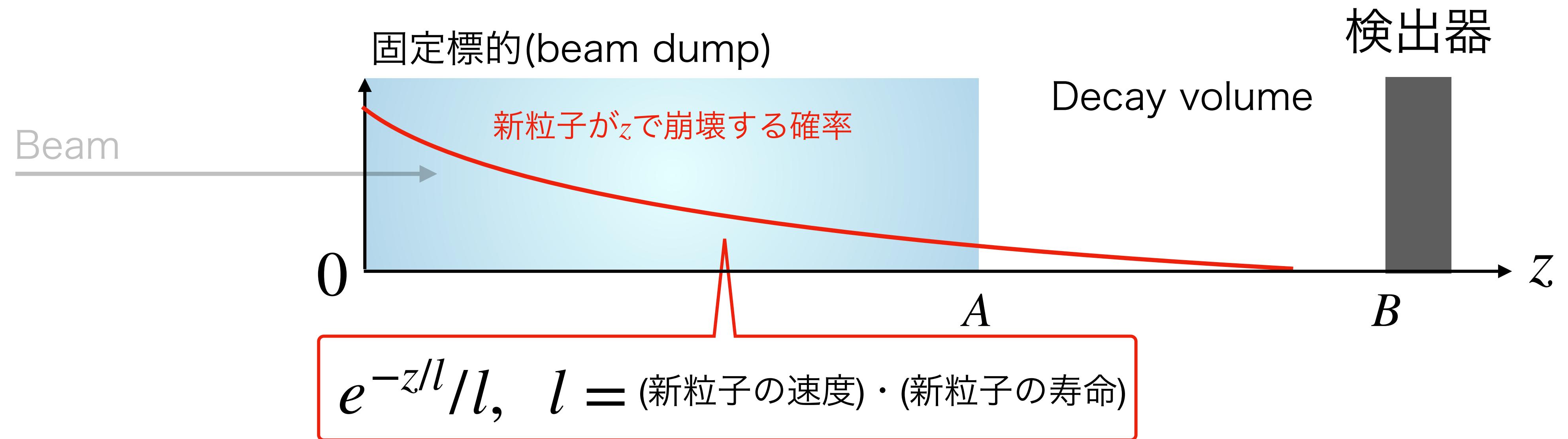
# アクセプタンス (1)

- 生成された新粒子が固定標的中で崩壊すると、検出器で新粒子の効果が見えない



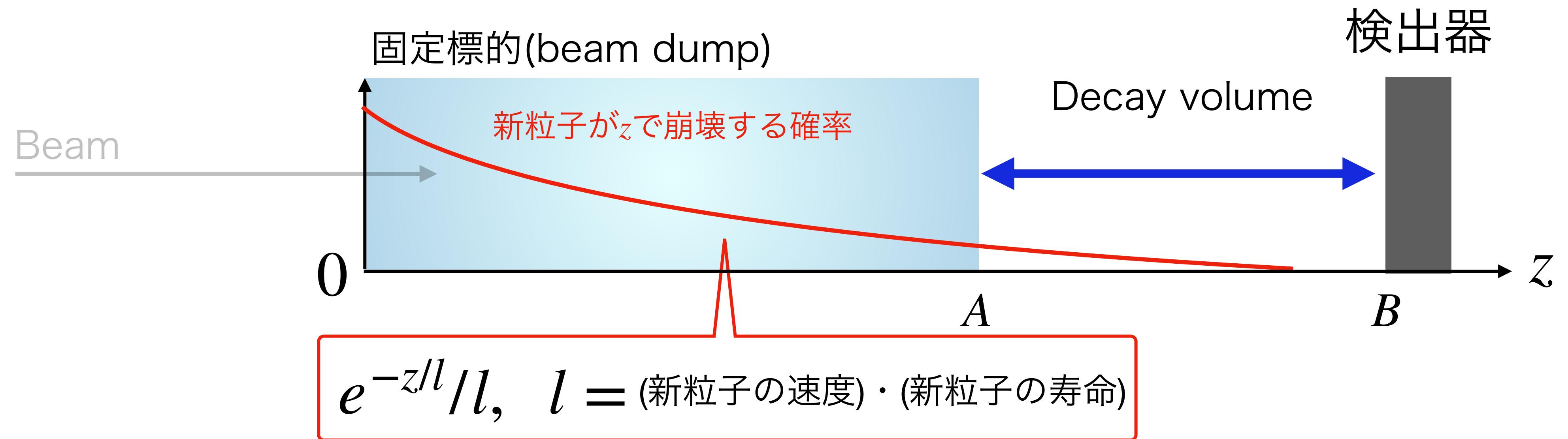
# アクセプタンス (1)

- 生成された新粒子が固定標的中で崩壊すると、検出器で新粒子の効果が見えない



# アクセプタンス (1)

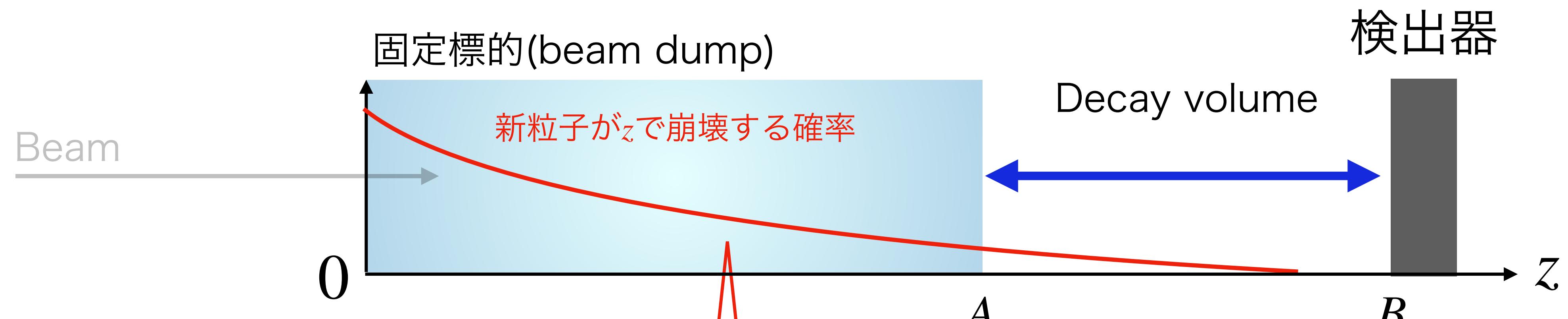
- 生成された新粒子が固定標的中で崩壊すると、検出器で新粒子の効果が見えない



(検出器に入る新粒子イベントの数) = (Decay volumeで崩壊する確率) × (生成された新粒子の数)

# アクセプタンス (1)

- 生成された新粒子が固定標的中で崩壊すると、検出器で新粒子の効果が見えない



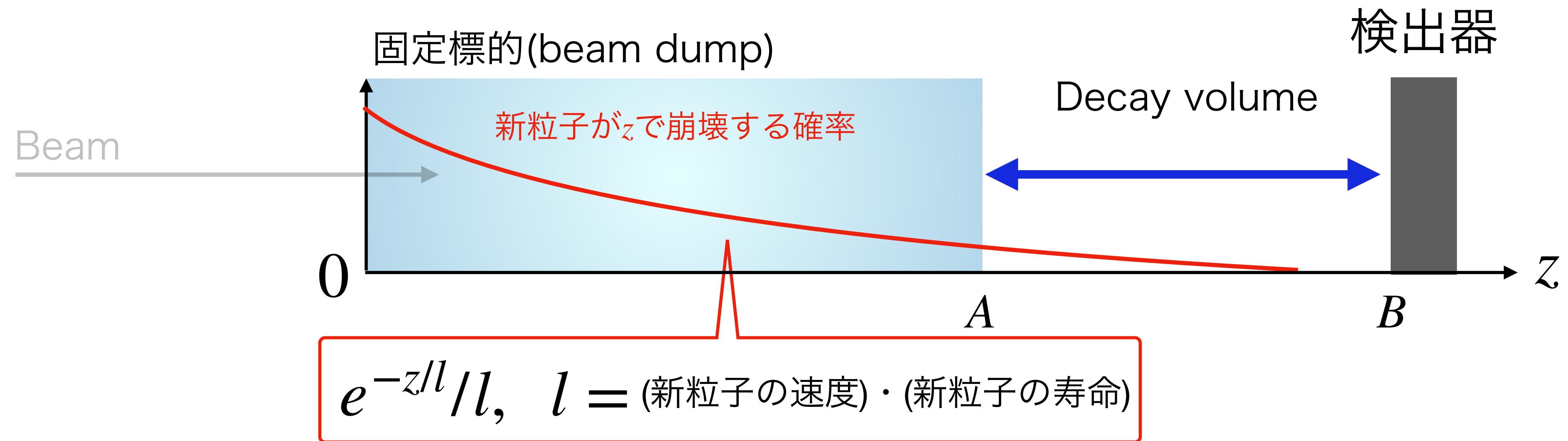
$$e^{-z/l}/l, \quad l = (\text{新粒子の速度}) \cdot (\text{新粒子の寿命})$$

(検出器に入る新粒子イベントの数) = (Decay volumeで崩壊する確率) × (生成された新粒子の数)

$$\int_A^B dz e^{-z/l}/l = e^{-A/l} \times (1 - e^{-(B-A)/l})$$

# アクセプタンス (1)

- 生成された新粒子が固定標的中で崩壊すると、検出器で新粒子の効果が見えない



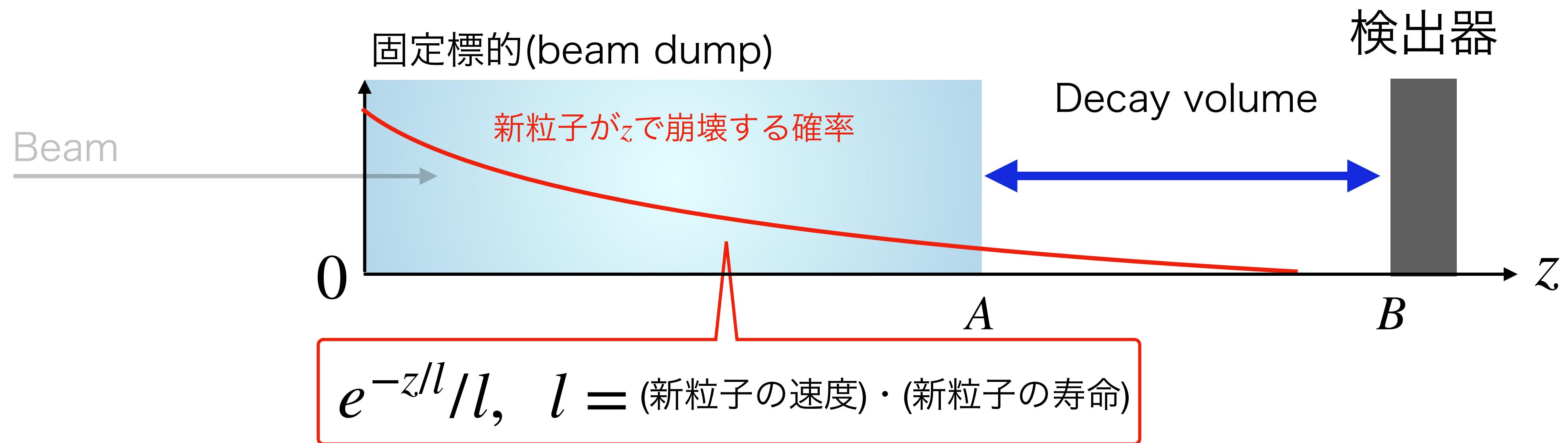
(検出器に入る新粒子イベントの数) = (Decay volumeで崩壊する確率) × (生成された新粒子の数)

$$\int_A^B dz e^{-z/l}/l = e^{-A/l} \times (1 - e^{-(B-A)/l}) \simeq e^{-A/l}$$

短寿命極限 ( $l$ が小さい)

# アクセプタンス (1)

- 生成された新粒子が固定標的中で崩壊すると、検出器で新粒子の効果が見えない



(検出器に入る新粒子イベントの数) = (Decay volumeで崩壊する確率) × (生成された新粒子の数)

$$\int_A^B dz e^{-z/l}/l = e^{-A/l} \times (1 - e^{-(B-A)/l}) \simeq e^{-A/l}$$

短寿命極限 ( $l$ が小さい)

$$\Rightarrow e^{-A/l} \times (\text{生成された新粒子の数}) \quad \text{短寿命極限 ( $l$ が小さい)}$$

# アクセプタンス (1)

短寿命極限 ( $l$ が小さい)

(検出器に入る新粒子イベントの数)  $\Rightarrow e^{-A/l} \times$  (生成された新粒子の数)

# アクセプタンス (1)

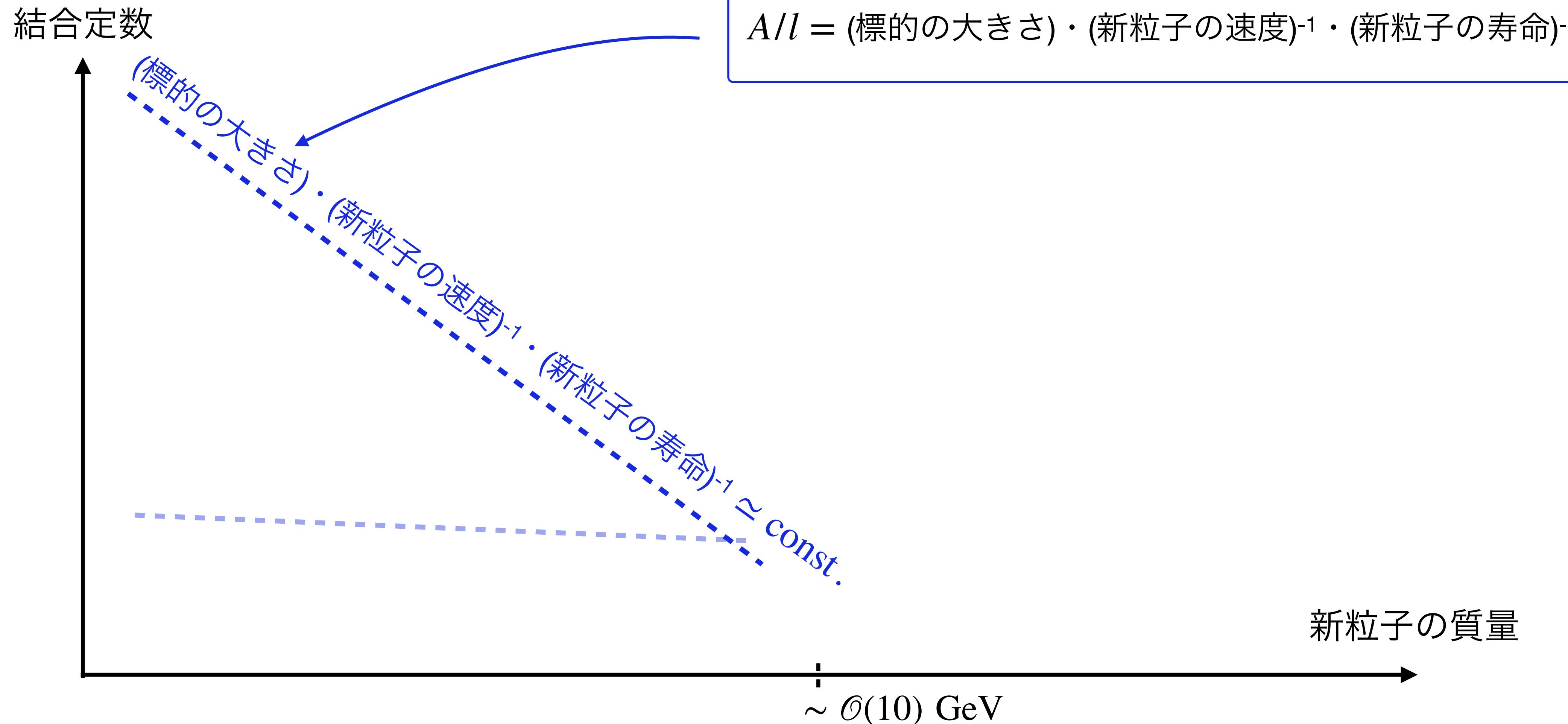
短寿命極限 ( $l$ が小さい)

(検出器に入る新粒子イベントの数)  $\Rightarrow e^{-A/l} \times$  (生成された新粒子の数)

$$A/l = (\text{標的の大きさ}) \cdot (\text{新粒子の速度})^{-1} \cdot (\text{新粒子の寿命})^{-1}$$

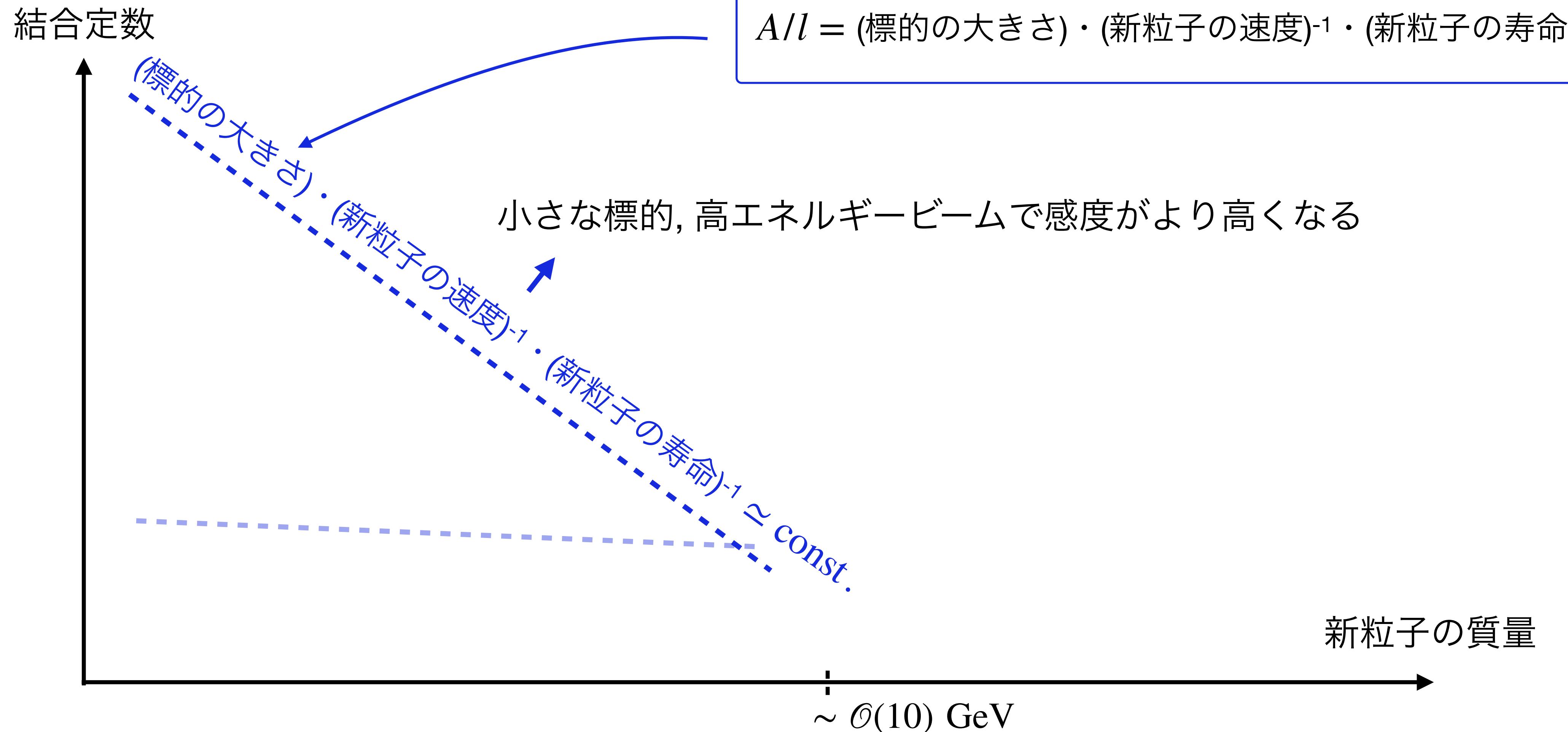
# アクセプタンス (1)

短寿命極限 ( $l$ が小さい)  
(検出器に入る新粒子イベントの数)  $\Rightarrow e^{-A/l} \times (\text{生成された新粒子の数})$



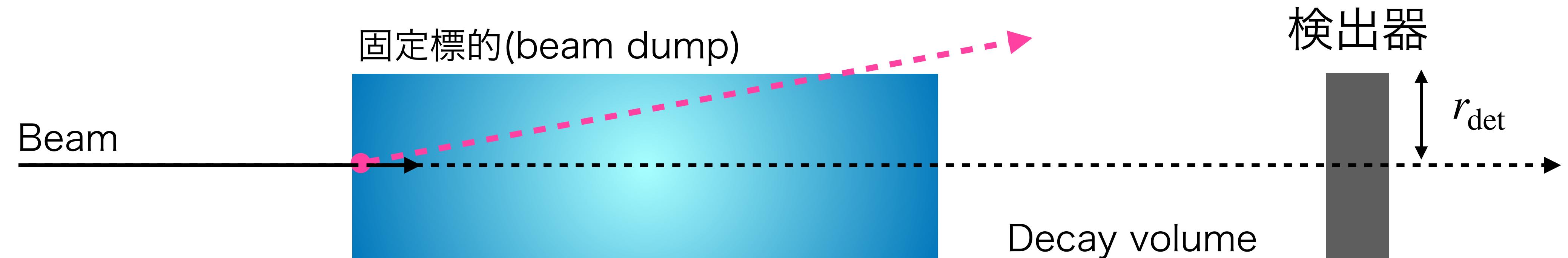
# アクセプタンス (1)

短寿命極限 ( $l$ が小さい)  
(検出器に入る新粒子イベントの数)  $\Rightarrow e^{-A/l} \times (\text{生成された新粒子の数})$



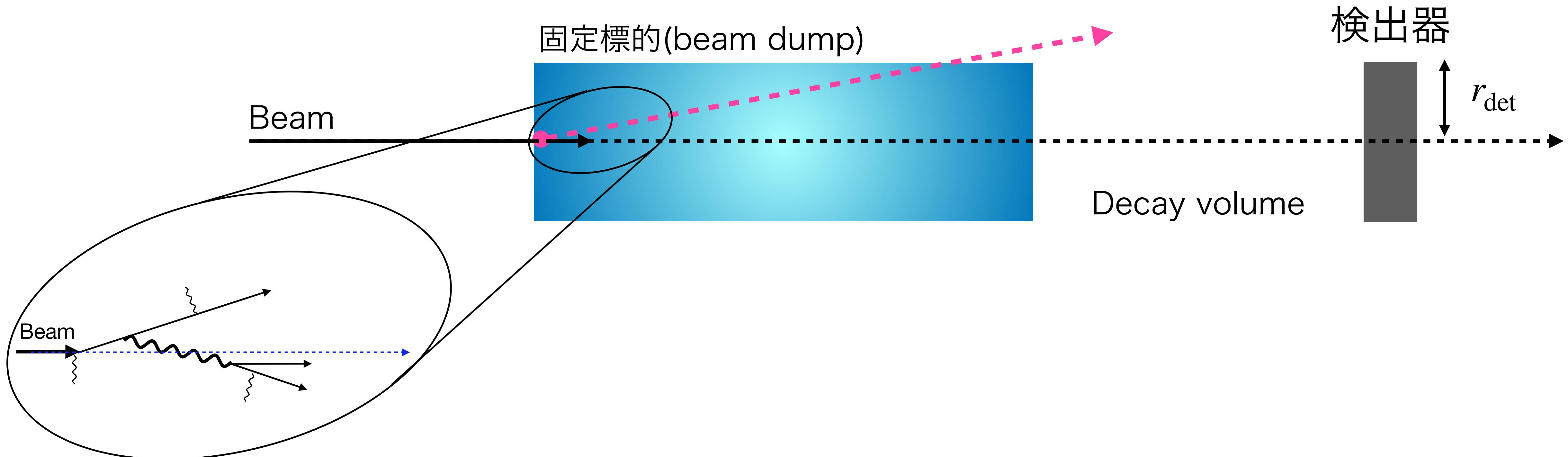
## アクセプタンス (2)

- 生成された新粒子の角度が広がりすぎると検出器に入らない



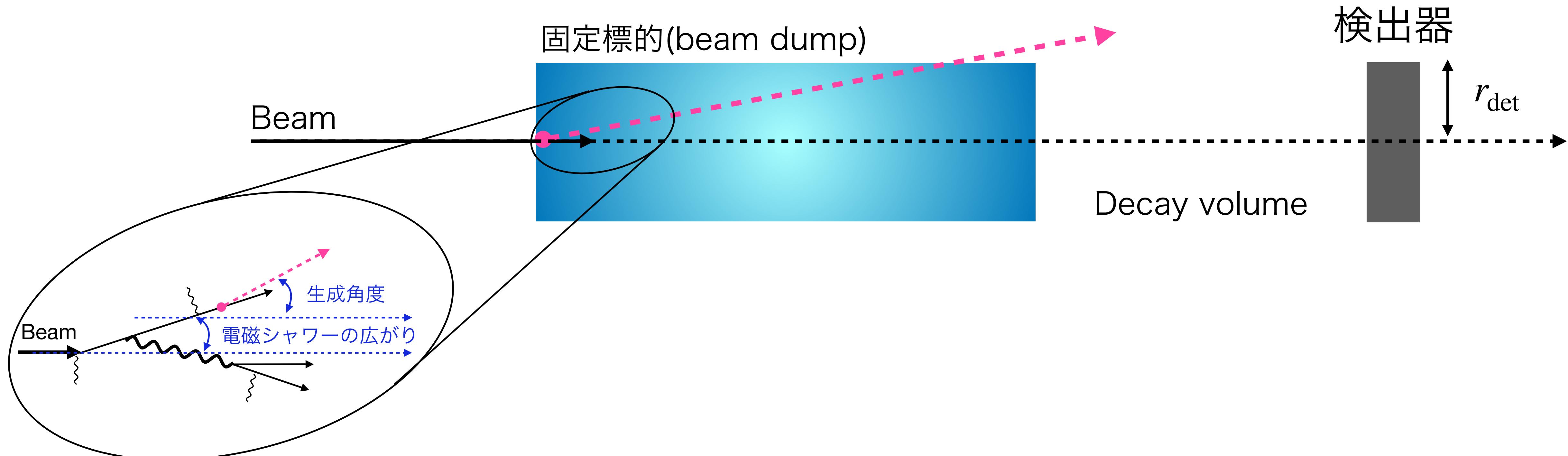
# アクセプタンス (2)

- 生成された新粒子の角度が広がりすぎると検出器に入らない



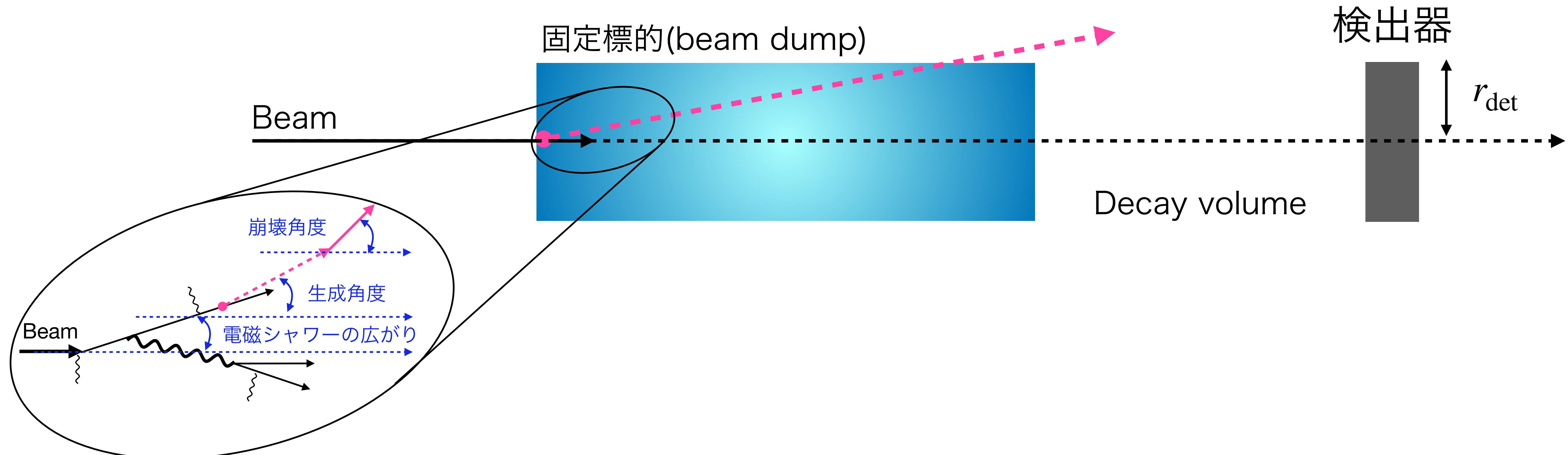
# アクセプタンス (2)

- 生成された新粒子の角度が広がりすぎると検出器に入らない



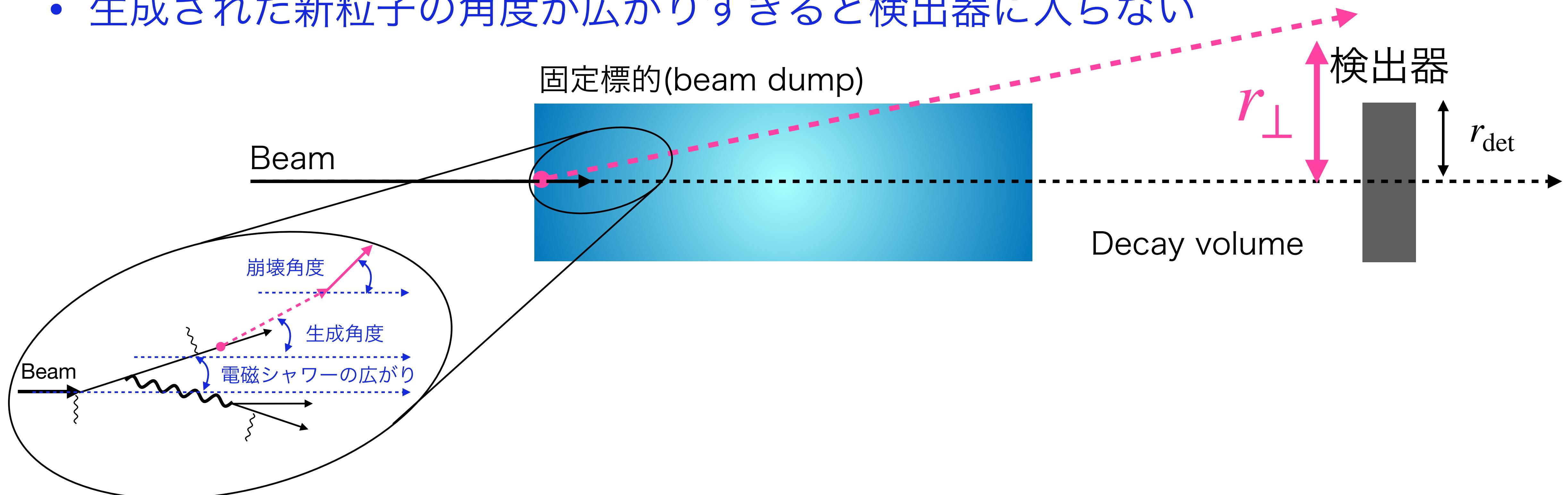
# アクセプタンス (2)

- 生成された新粒子の角度が広がりすぎると検出器に入らない



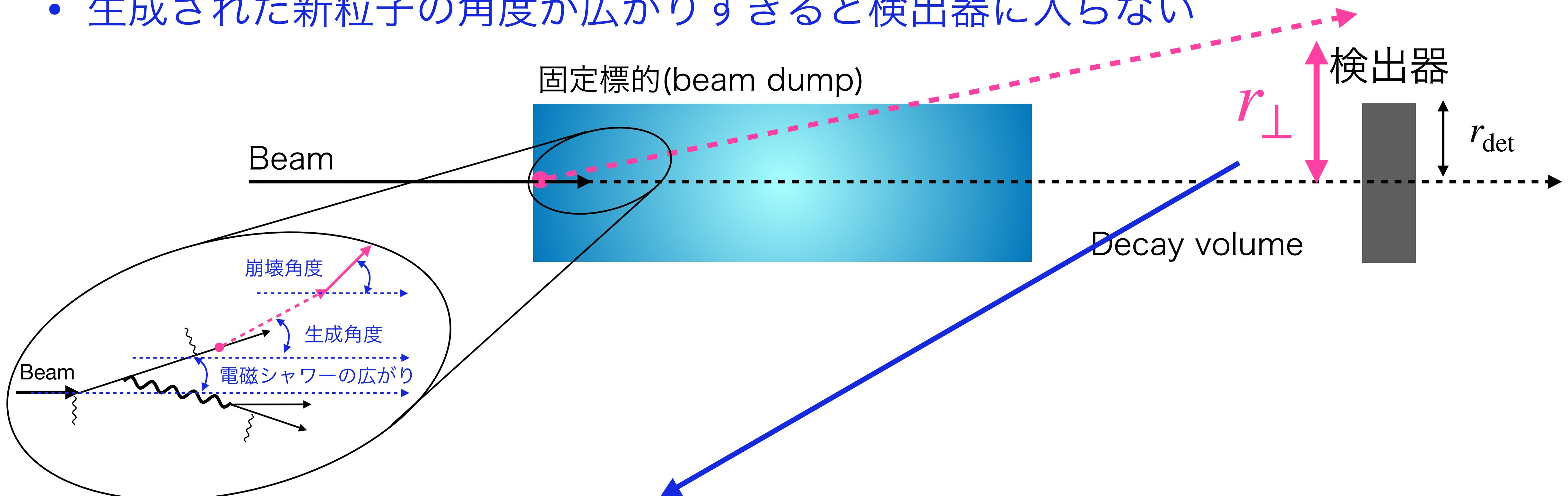
# アクセプタンス (2)

- 生成された新粒子の角度が広がりすぎると検出器に入らない



## アクセプタンス (2)

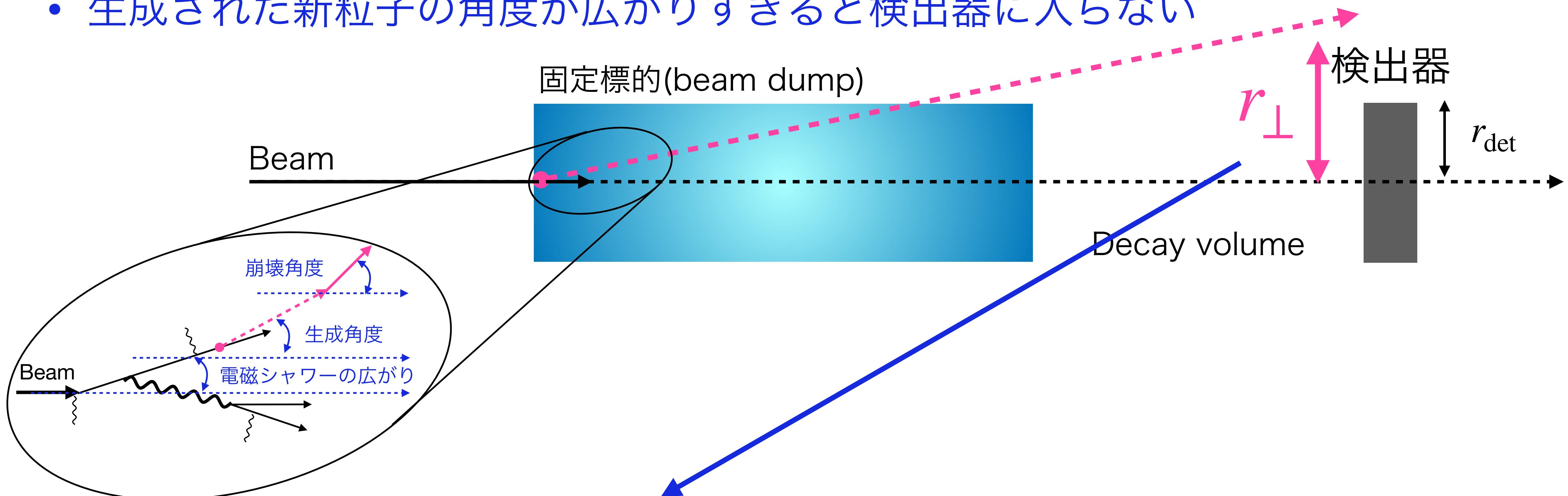
- 生成された新粒子の角度が広がりすぎると検出器に入らない



$$(\text{検出器に入る新粒子イベントの数}) = \Theta(r_{det} - r_{\perp}) \times (\text{Decay volumeで崩壊する確率}) \times (\text{生成された新粒子の数})$$

## アクセプタンス (2)

- 生成された新粒子の角度が広がりすぎると検出器に入らない

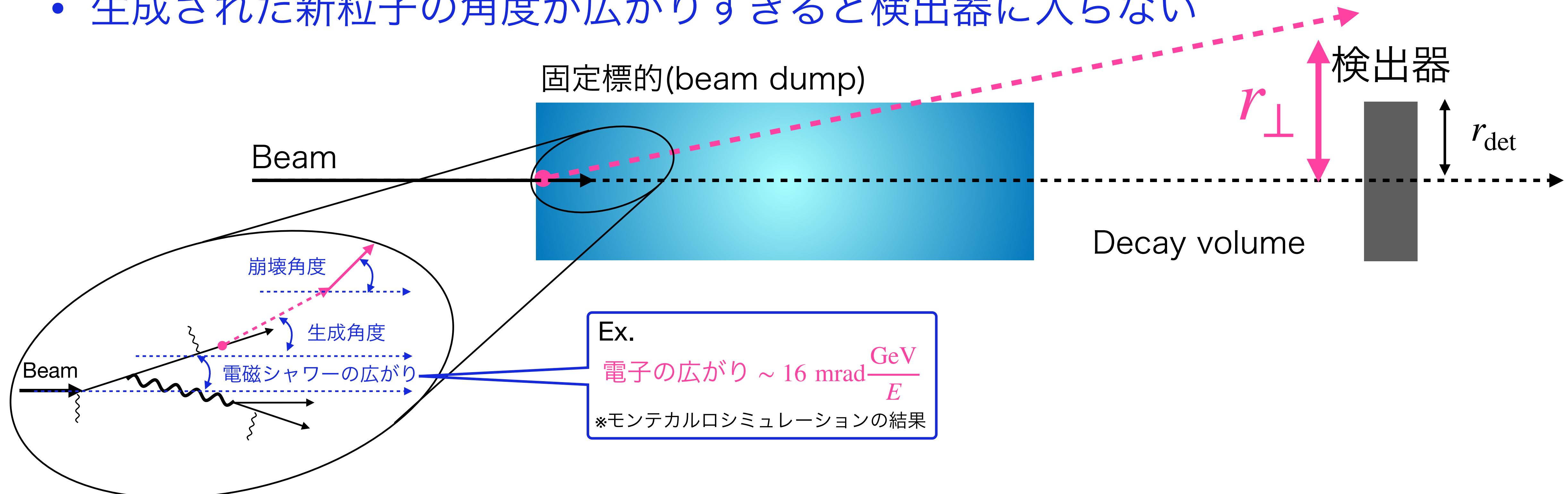


(検出器に入る新粒子イベントの数) =  $\Theta(r_{det} - r_{\perp}) \times (\text{Decay volumeで崩壊する確率}) \times (\text{生成された新粒子の数})$

$r_{det} > r_{\perp}$  のとき新粒子イベントを検出できる

# アクセプタンス (2)

- 生成された新粒子の角度が広がりすぎると検出器に入らない

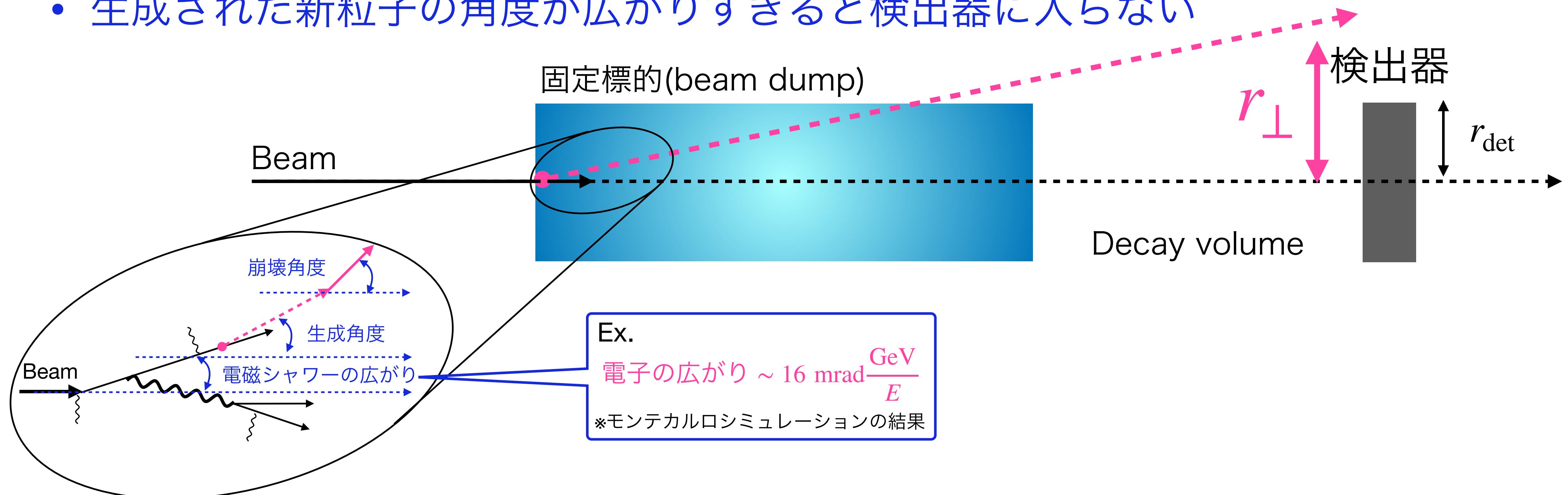


(検出器に入る新粒子イベントの数) =  $\Theta(r_{\text{det}} - r_{\perp}) \times (\text{Decay volumeで崩壊する確率}) \times (\text{生成された新粒子の数})$

$r_{\text{det}} > r_{\perp}$  のとき新粒子イベントを検出できる

# アクセプタンス (2)

- 生成された新粒子の角度が広がりすぎると検出器に入らない

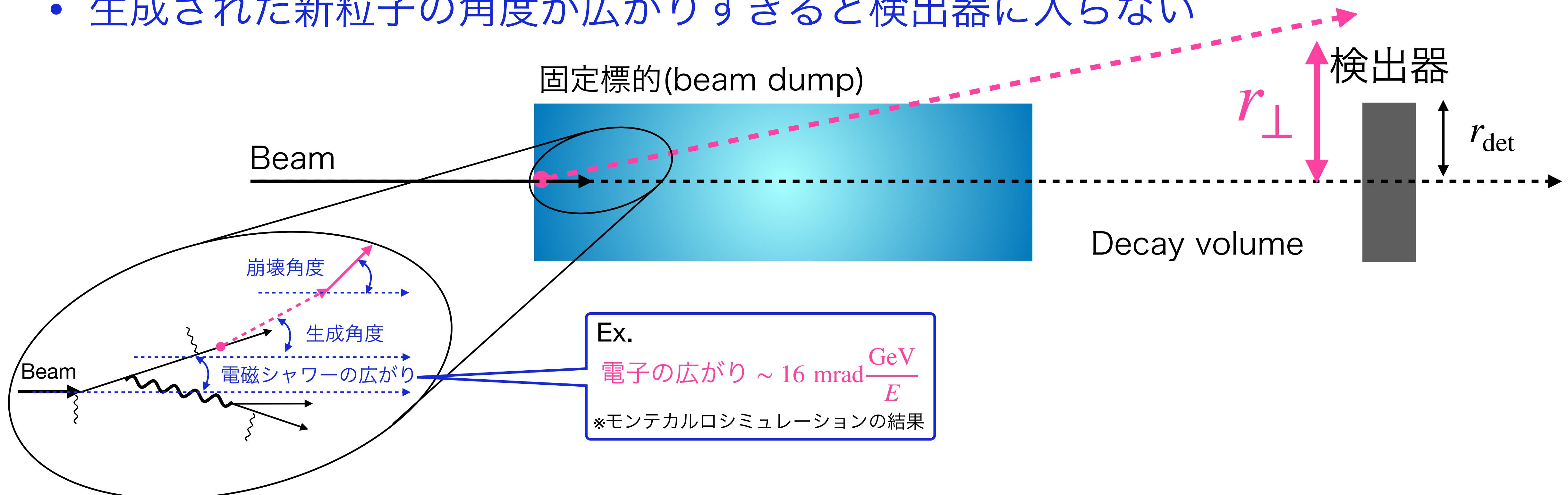


(検出器に入る新粒子イベントの数) =  $\Theta(r_{\text{det}} - r_{\perp}) \times (\text{Decay volumeで崩壊する確率}) \times (\text{生成された新粒子の数})$

$r_{\text{det}} > r_{\perp}$  のとき新粒子イベントを検出できる  $\Rightarrow$  イベントに寄与する最小エネルギーが決まる

# アクセプタンス (2)

- 生成された新粒子の角度が広がりすぎると検出器に入らない



(検出器に入る新粒子イベントの数) =  $\Theta(r_{\text{det}} - r_{\perp}) \times (\text{Decay volumeで崩壊する確率}) \times (\text{生成された新粒子の数})$

$r_{\text{det}} > r_{\perp}$  のとき新粒子イベントを検出できる  $\Rightarrow$  イベントに寄与する最小エネルギーが決まる

## アクセプタンス (2)

- アクセプタンスを入れたイベント数の公式：

(イベントの数) = (生成された新粒子の数) × (Decay volumeで崩壊する確率) ×  $\Theta(r_{\text{det}} - r_{\perp})$

## アクセプタンス (2)

- アクセプタンスを入れたイベント数の公式：

アクセプタンス

$$(\text{イベントの数}) = (\text{生成された新粒子の数}) \times (\text{Decay volumeで崩壊する確率}) \times \Theta(r_{\text{det}} - r_{\perp})$$

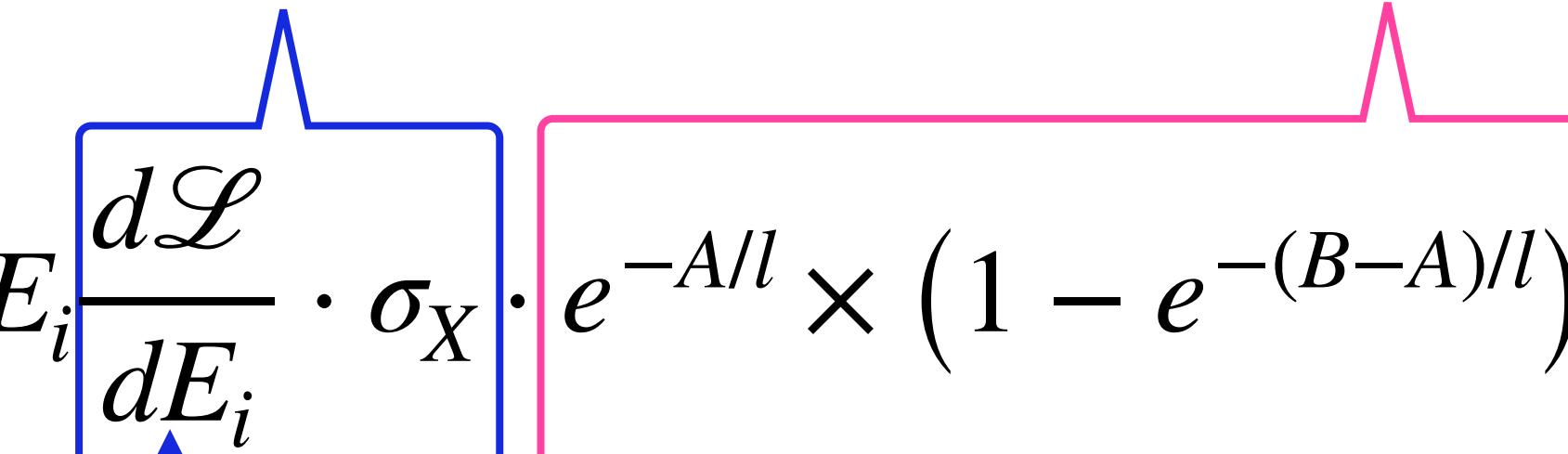
## アクセプタンス (2)

- アクセプタンスを入れたイベント数の公式：

(イベントの数) = (生成された新粒子の数) × (Decay volumeで崩壊する確率) ×  $\Theta(r_{\text{det}} - r_{\perp})$

$$= \int^{E_{\text{beam}}} dE_i \frac{d\mathcal{L}}{dE_i} \cdot \sigma_X \cdot e^{-A/l} \times (1 - e^{-(B-A)/l}) \cdot \Theta(r_{\text{det}} - r_{\perp})$$

↑  
ルミノシティ



# アクセプタンス（2）

- ・アクセプタンスを入れたイベント数の公式：

(イベントの数) = (生成された新粒子の数) × (Decay volumeで崩壊する確率) ×  $\Theta(r_{\text{det}} - r_{\perp})$

$$= \int_{E_{\min}}^{E_{\text{beam}}} dE_i \frac{d\mathcal{L}}{dE_i} \cdot \sigma_X \cdot e^{-A/l} \times (1 - e^{-(B-A)/l}) \cdot \Theta(r_{\text{det}} - r_{\perp})$$

ルミノシティ

結合定数の小さい極限

$$\propto \int_{E_{\min}}^{E_{\text{beam}}} dE_i \left( \frac{E_{\text{beam}}}{E_i^2} \right) \cdot \sigma_X \cdot \frac{B - A}{l}$$

# アクセプタンス (2)

- アクセプタンスを入れたイベント数の公式：

(イベントの数) = (生成された新粒子の数) × (Decay volumeで崩壊する確率) ×  $\Theta(r_{\text{det}} - r_{\perp})$

$$= \int^{E_{\text{beam}}} dE_i \frac{d\mathcal{L}}{dE_i} \cdot \sigma_X \cdot e^{-A/l} \times (1 - e^{-(B-A)/l}) \cdot \Theta(r_{\text{det}} - r_{\perp})$$

ルミノシティ

結合定数の小さい極限

$$\propto \int^{E_{\text{beam}}} dE_i \left( \frac{E_{\text{beam}}}{E_i^2} \right) \cdot \sigma_X \cdot \frac{B - A}{l}$$

$E_{\text{min}}$

アクセプタンスで決まる最小エネルギー

# アクセプタンス (2)

- アクセプタンスを入れたイベント数の公式：

(イベントの数) = (生成された新粒子の数) × (Decay volumeで崩壊する確率) ×  $\Theta(r_{\text{det}} - r_{\perp})$

$$= \int^{E_{\text{beam}}} dE_i \frac{d\mathcal{L}}{dE_i} \cdot \sigma_X \cdot e^{-A/l} \times (1 - e^{-(B-A)/l}) \cdot \Theta(r_{\text{det}} - r_{\perp})$$

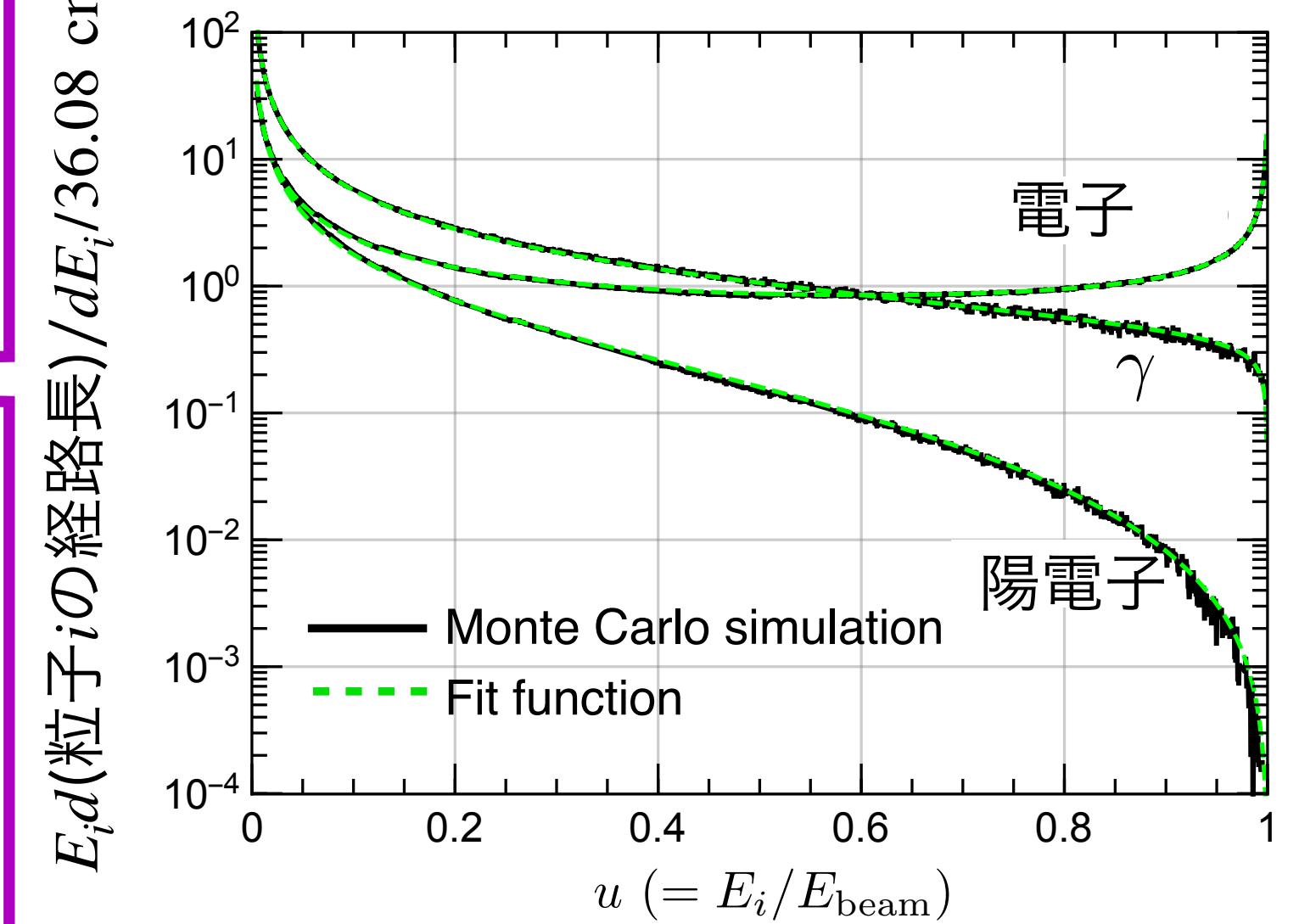
ルミノシティ

結合定数の小さい極限

$$\propto \int^{E_{\text{beam}}} dE_i \left( \frac{E_{\text{beam}}}{E_i^2} \right) \cdot \sigma_X \cdot \frac{B - A}{l}$$

アクセプタンスで決まる最小エネルギー

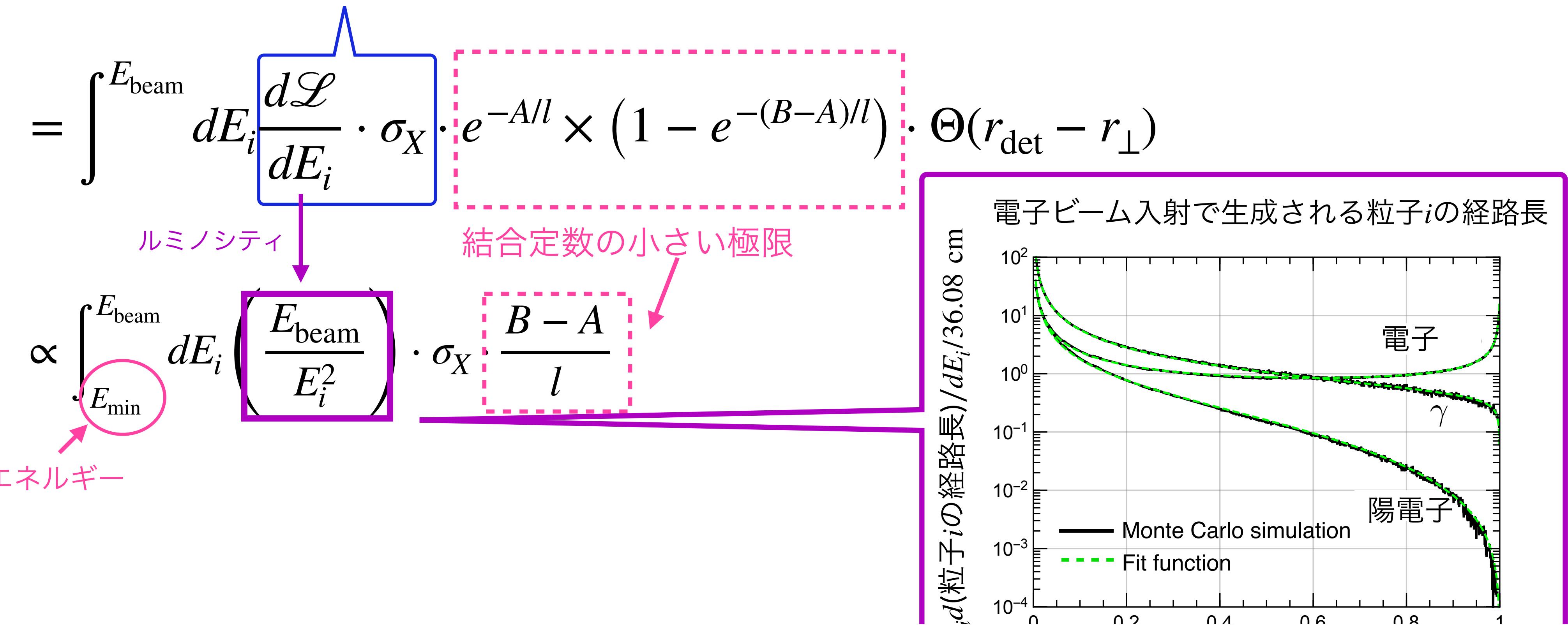
電子ビーム入射で生成される粒子*i*の経路長



# アクセプタンス (2)

- アクセプタンスを入れたイベント数の公式：

(イベントの数) = (生成された新粒子の数) × (Decay volumeで崩壊する確率) ×  $\Theta(r_{\text{det}} - r_{\perp})$



結合定数が小さな領域はアクセプタンスで決まる最小エネルギーでイベント数が決まる

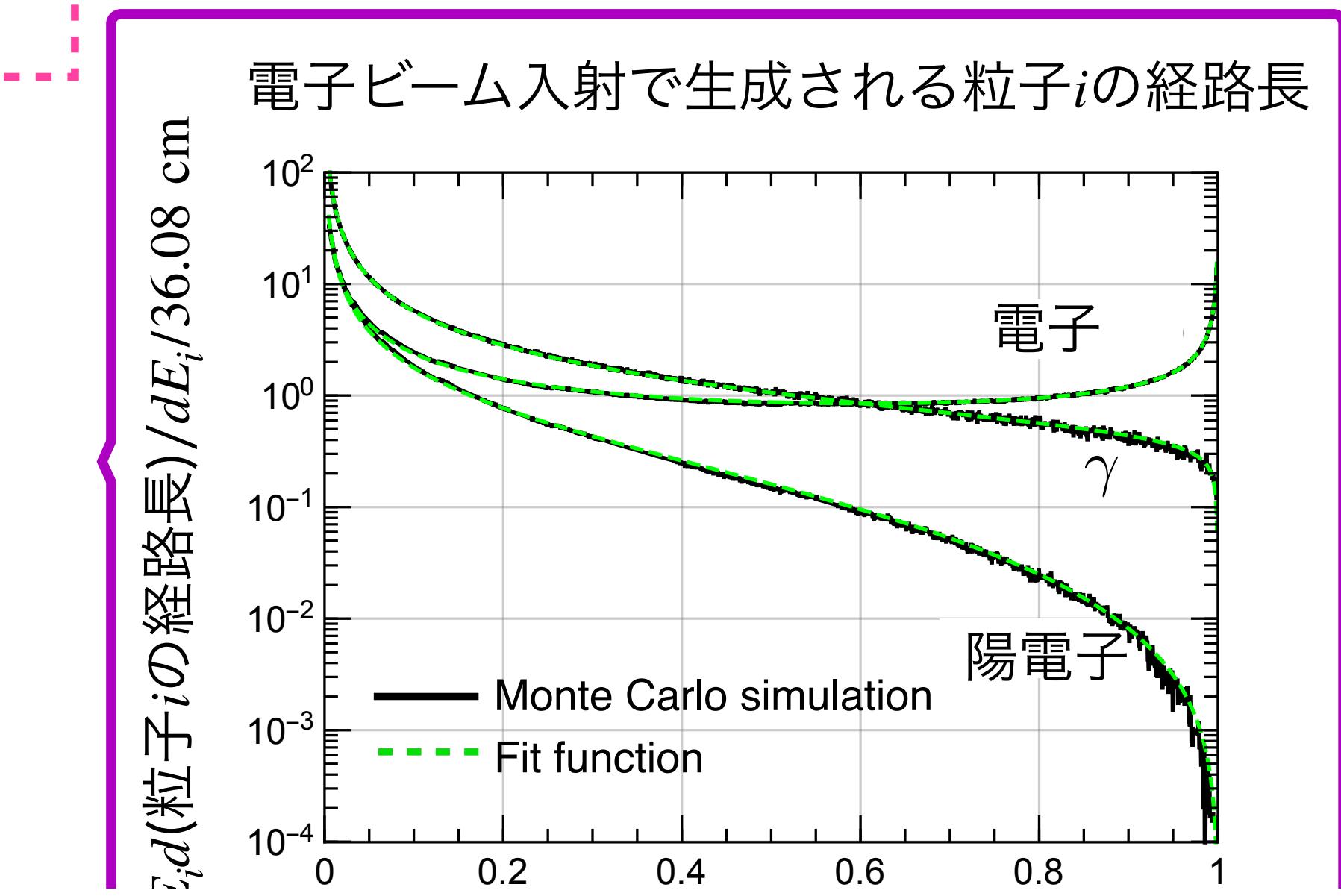
# アクセプタンス (2)

- アクセプタンスを入れたイベント数の公式：

(イベントの数) = (生成された新粒子の数) × (Decay volumeで崩壊する確率) ×  $\Theta(r_{\text{det}} - r_{\perp})$

$$= \int_{E_{\text{min}}}^{E_{\text{beam}}} dE_i \frac{d\mathcal{L}}{dE_i} \cdot \sigma_X \cdot e^{-A/l} \times (1 - e^{-(B-A)/l}) \cdot \Theta(r_{\text{det}} - r_{\perp})$$

$$\propto \int_{E_{\text{min}}}^{E_{\text{beam}}} dE_i \left( \frac{E_{\text{beam}}}{E_i^2} \right) \cdot \sigma_X \cdot \frac{B - A}{l}$$



結合定数が小さな領域はアクセプタンスで決まる最小エネルギーでイベント数が決まりうる

# アクセプタンス (2)

$$N_{\text{event}} \propto \int_{E_{\min}}^{E_{\text{beam}}} dE_i \left( \frac{E_{\text{beam}}}{E_i^2} \right) \cdot \sigma_X \cdot l^{-1} \cdot (B - A)$$

(小さな結合定数の極限)

## アクセプタンス (2)

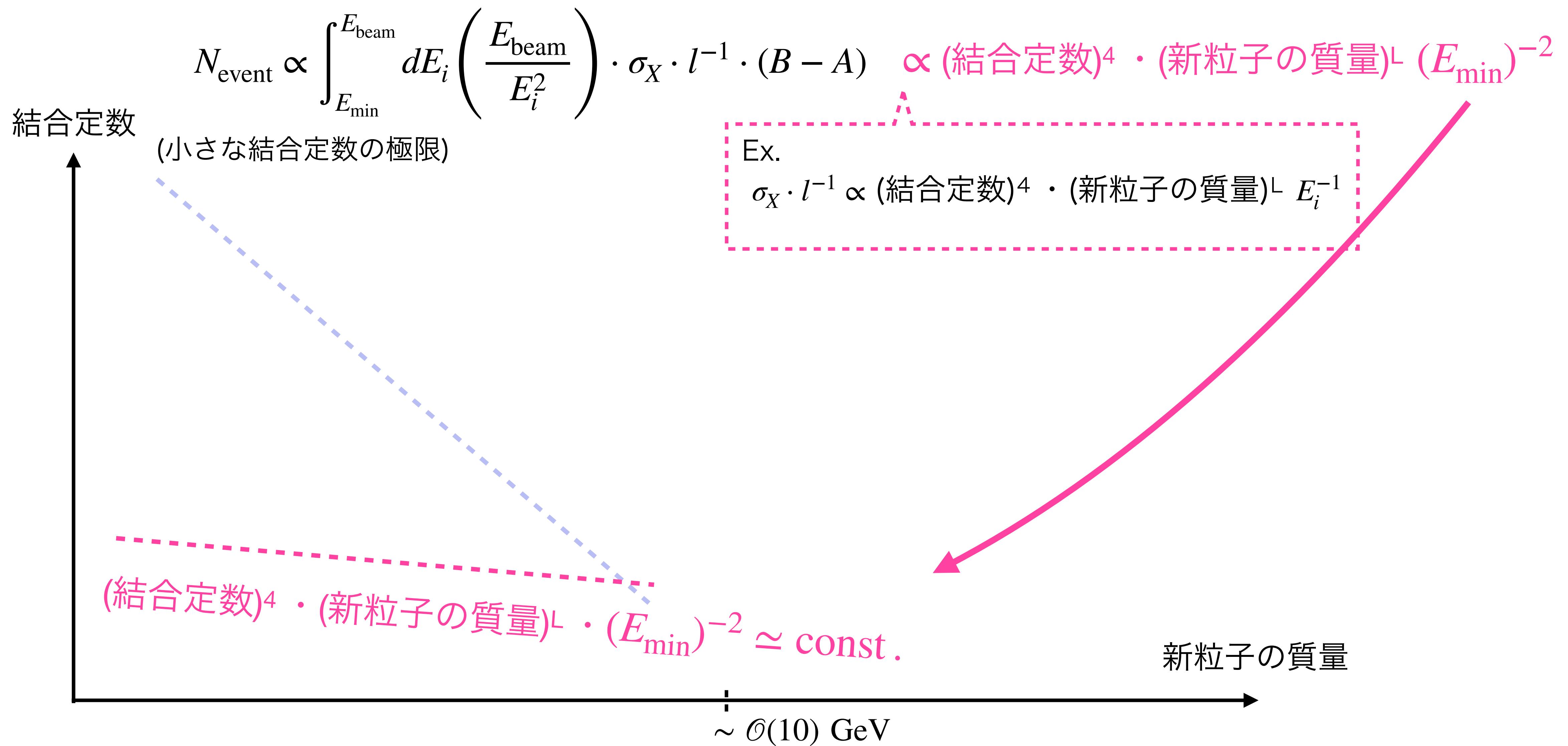
$$N_{\text{event}} \propto \int_{E_{\min}}^{E_{\text{beam}}} dE_i \left( \frac{E_{\text{beam}}}{E_i^2} \right) \cdot \sigma_X \cdot l^{-1} \cdot (B - A) \propto (\text{結合定数})^4 \cdot (\text{新粒子の質量})^{\perp} (E_{\min})^{-2}$$

(小さな結合定数の極限)

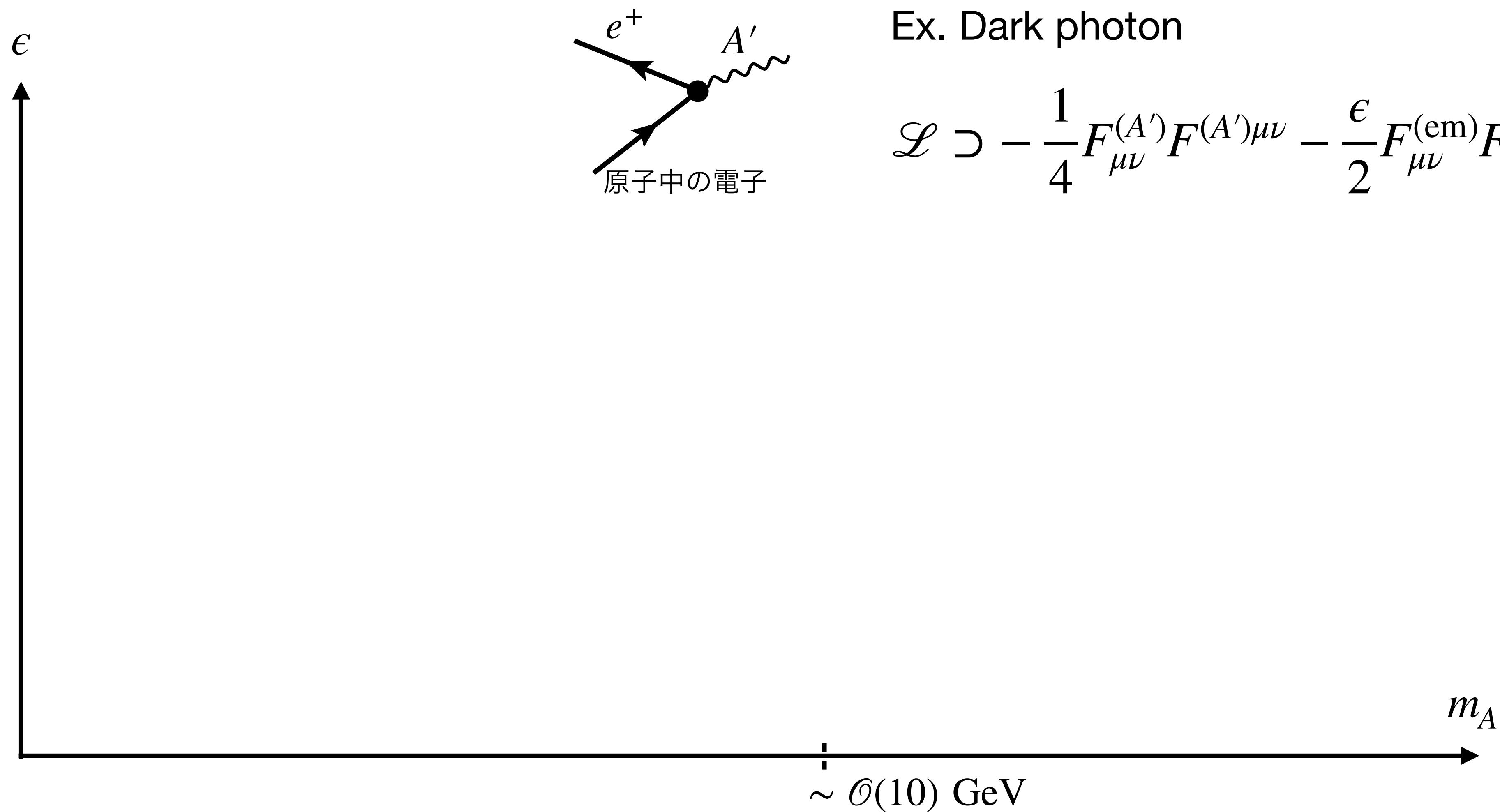
Ex.

$$\sigma_X \cdot l^{-1} \propto (\text{結合定数})^4 \cdot (\text{新粒子の質量})^{\perp} E_i^{-1}$$

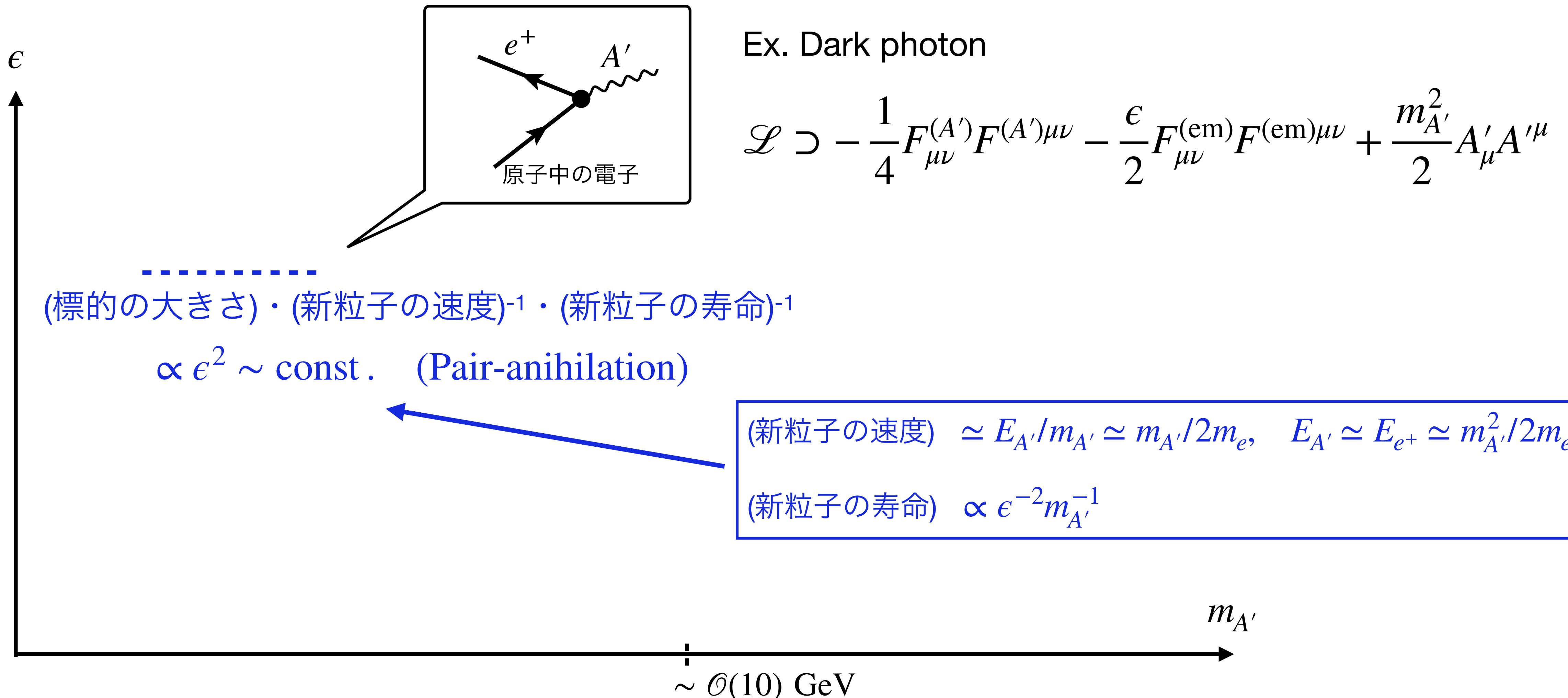
## アクセプタンス (2)



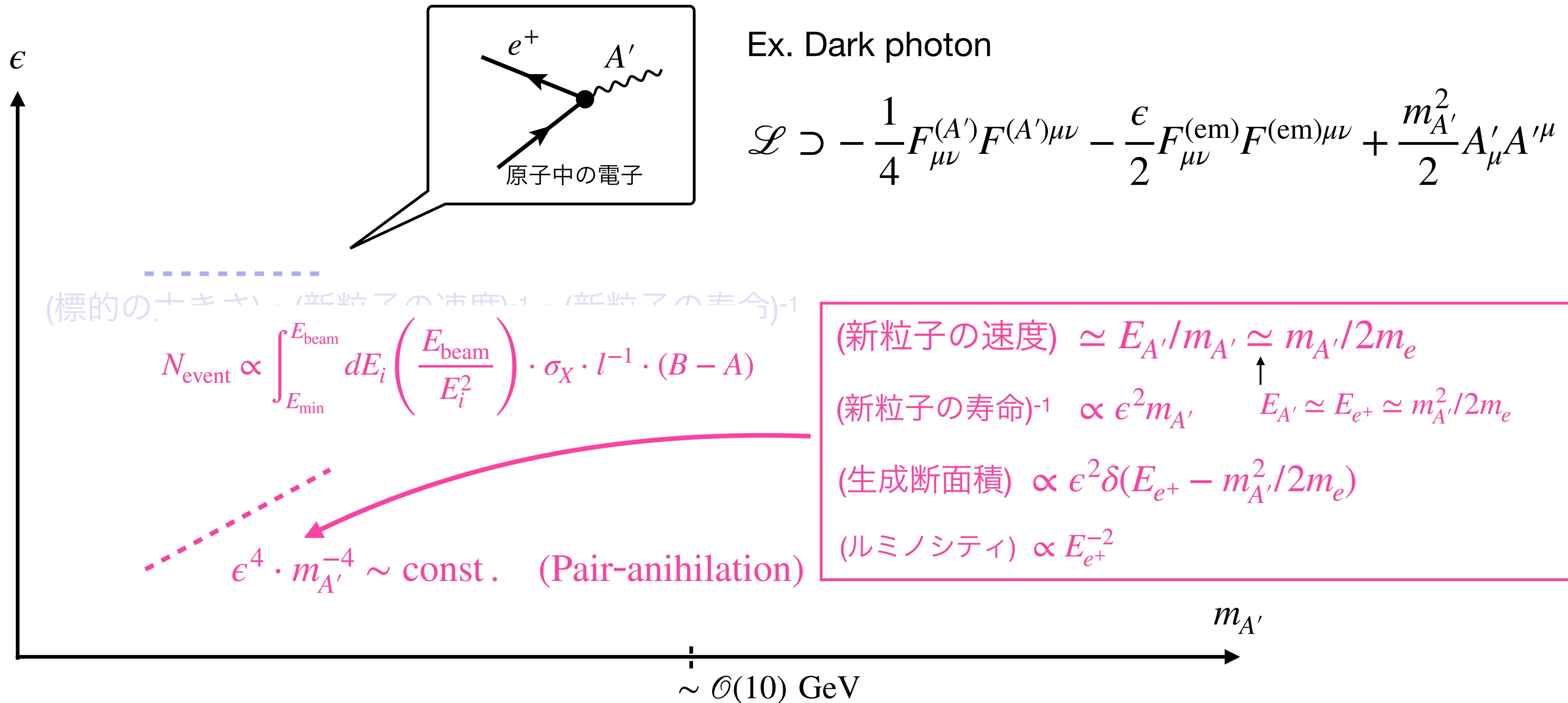
# 電子ビームダンプにおけるDark photon探査の感度



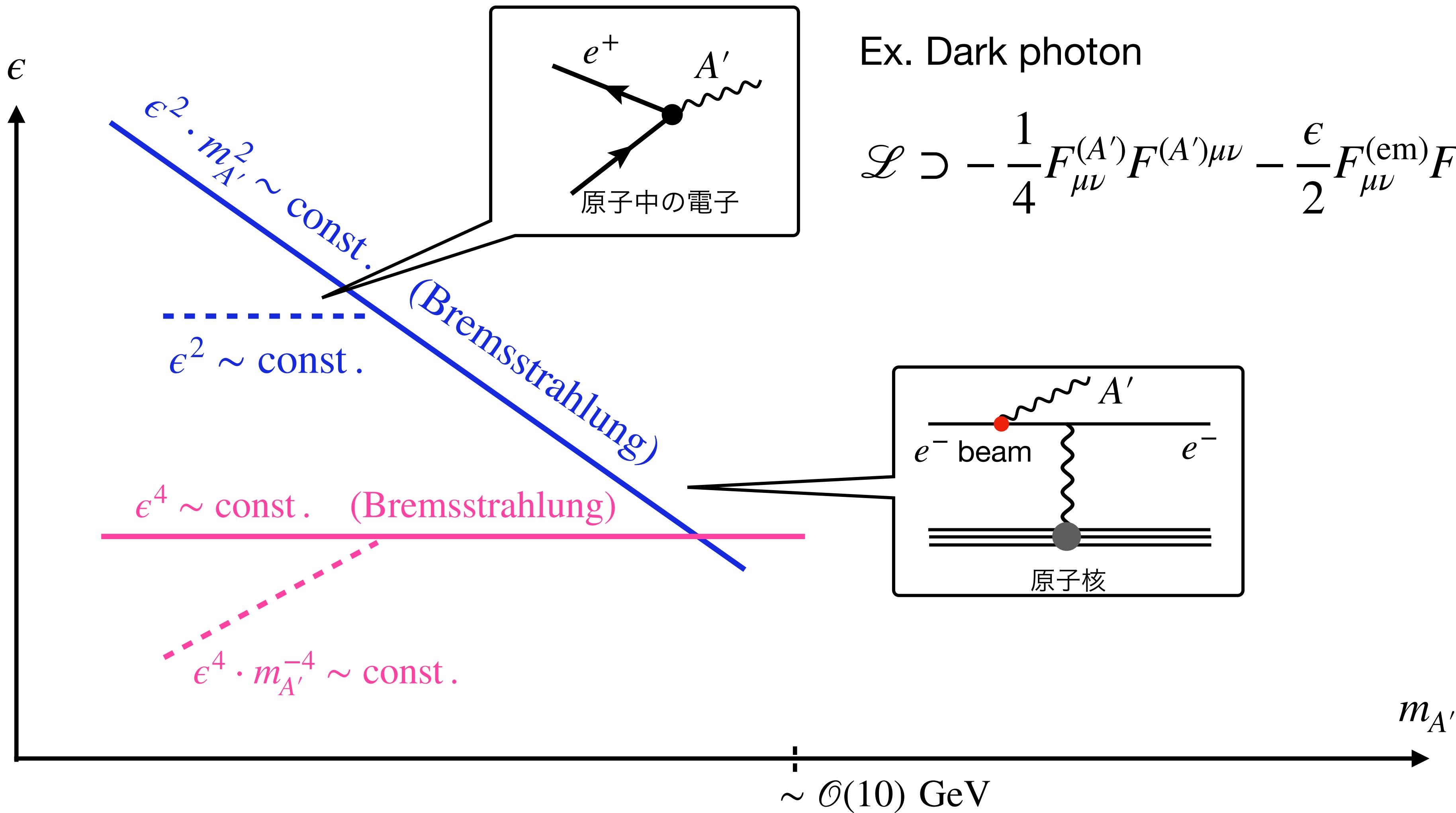
# 電子ビームダンプにおけるDark photon探査の感度



# 電子ビームダンプにおけるDark photon探査の感度

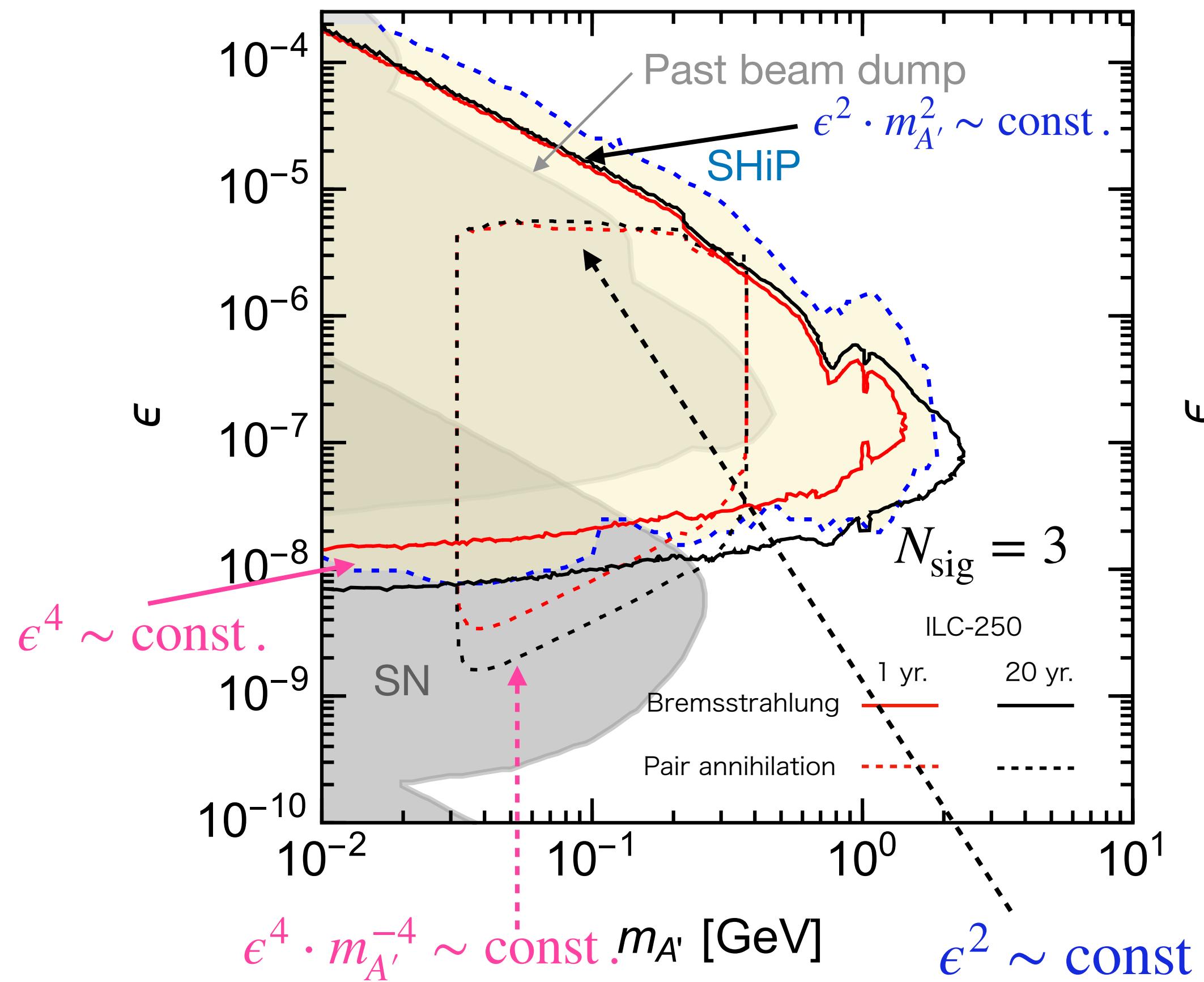


# 電子ビームダンプにおけるDark photon探査の感度

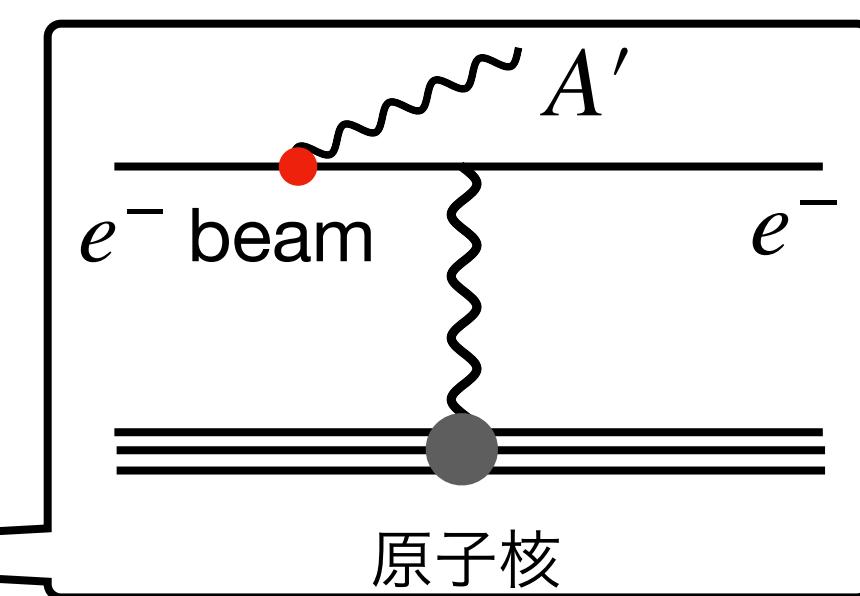
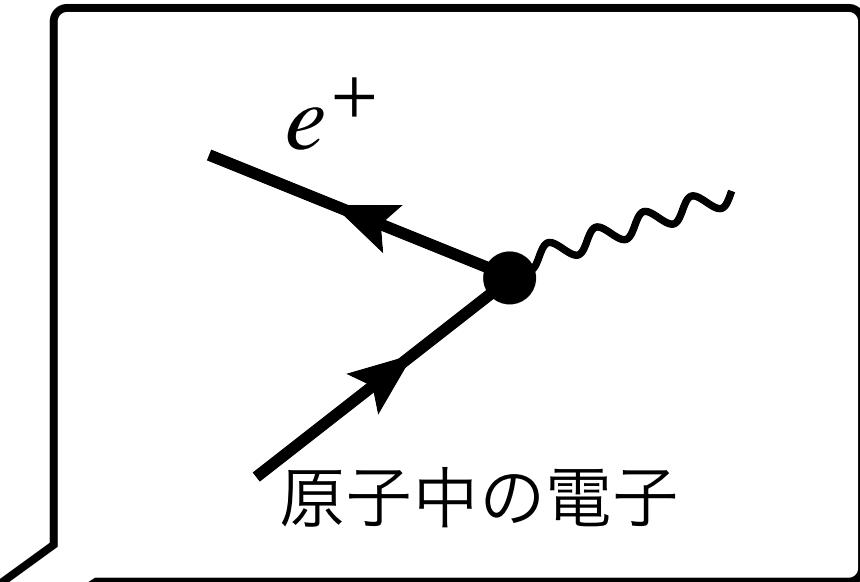
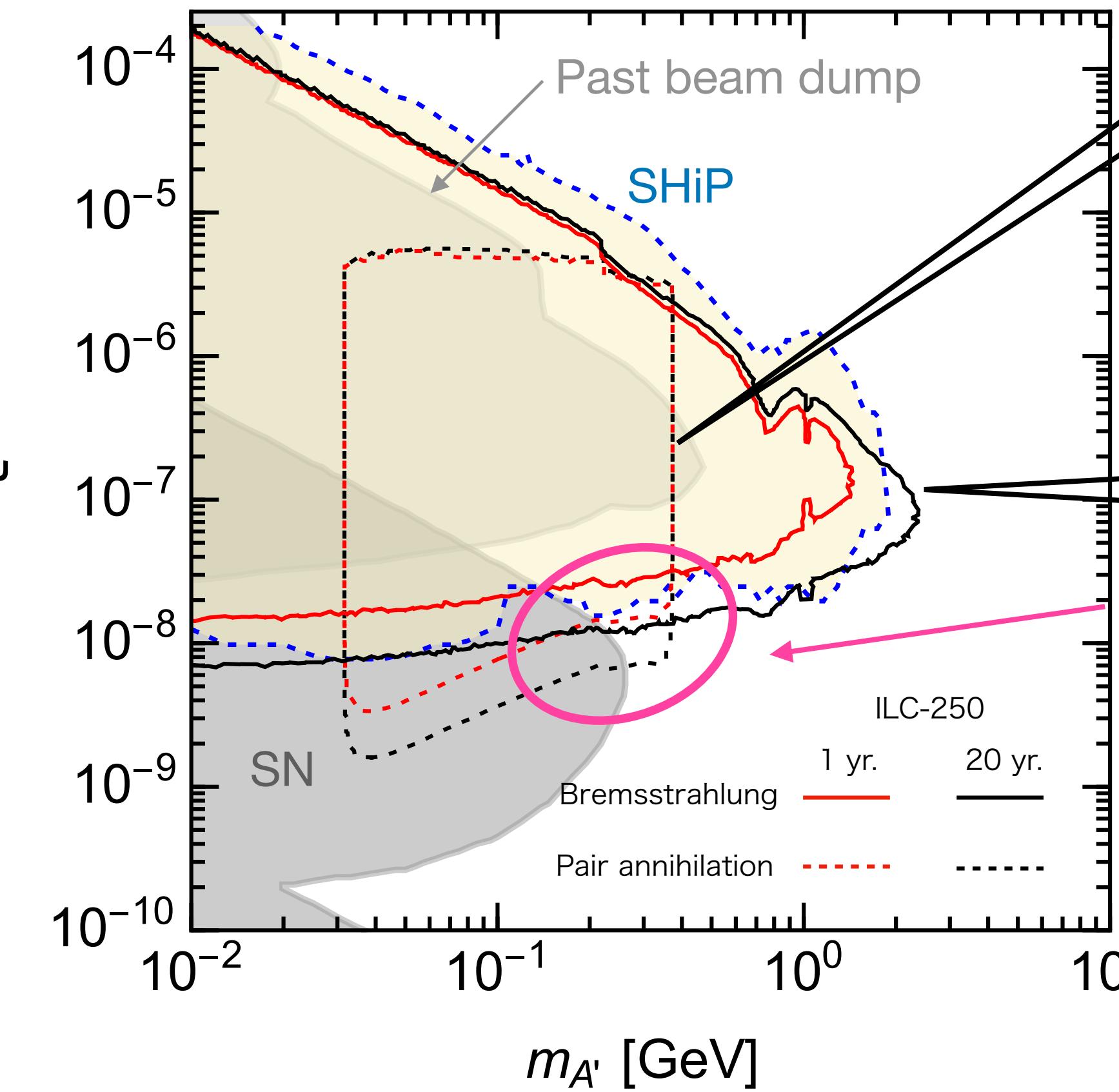


# 数値計算結果 (Dark photon)

電子ビームダンプ実験



陽電子ビームダンプ実験

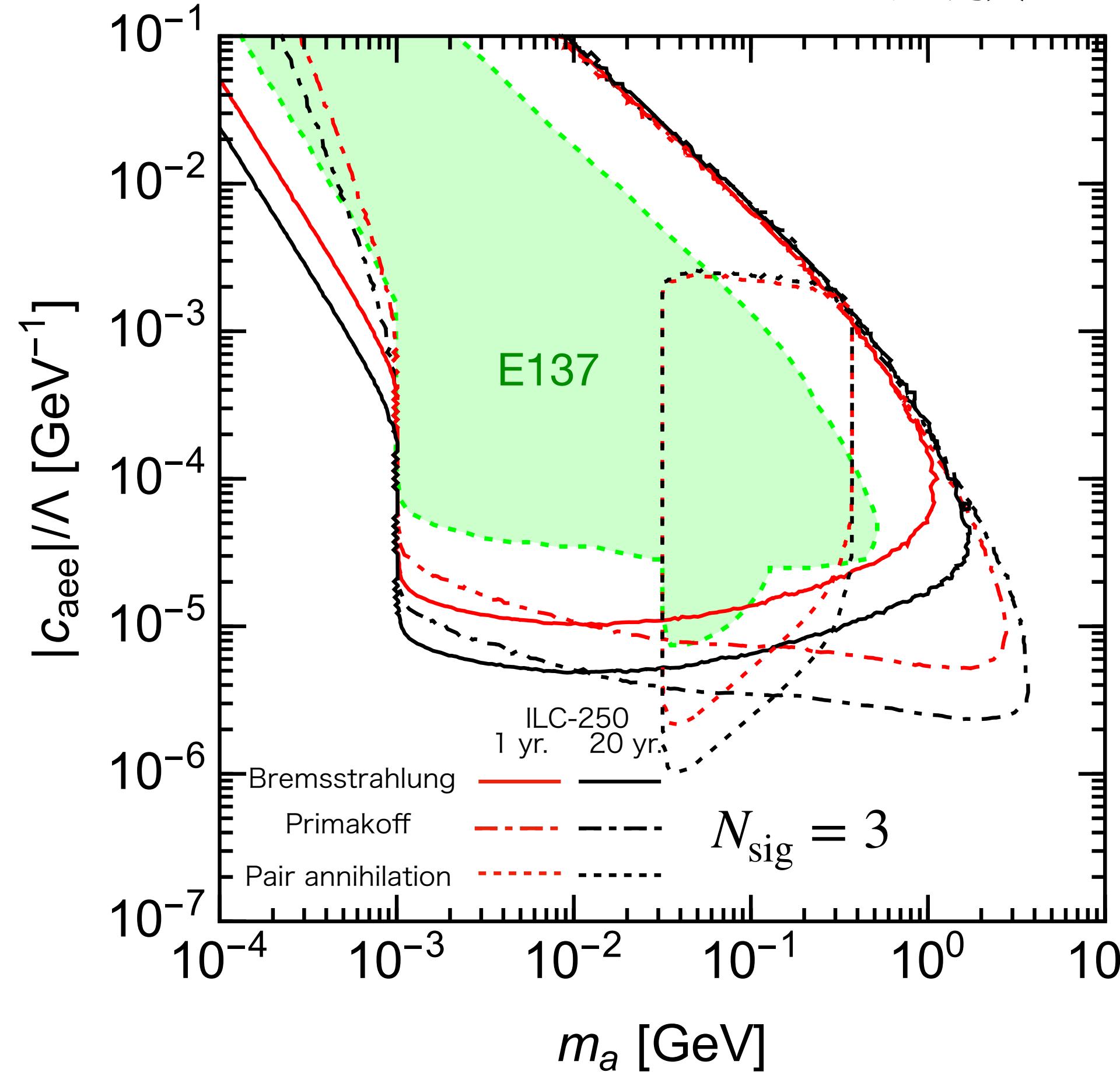


Primary beamの寄与

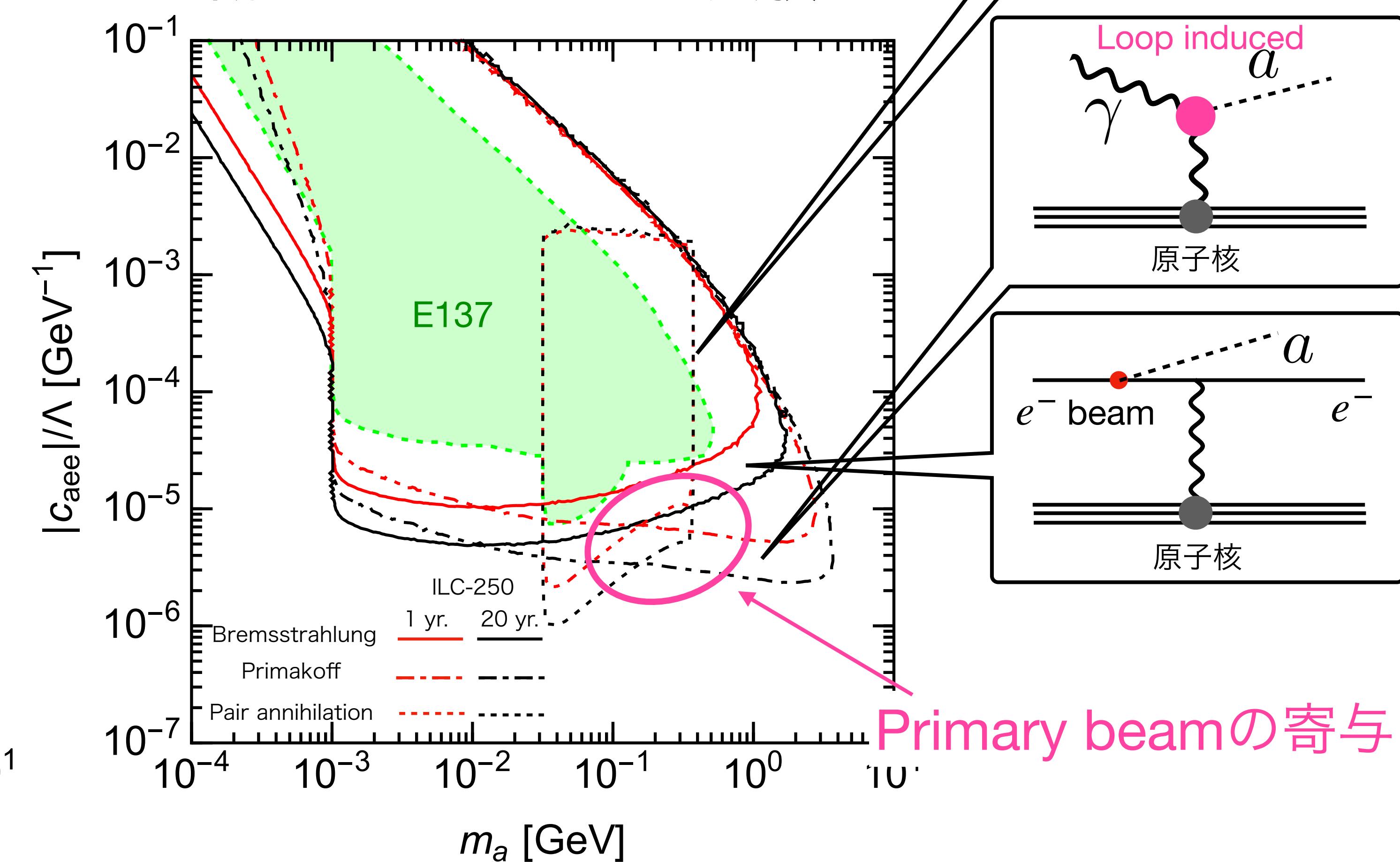
$$\text{Model: } \mathcal{L} \supset -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^{(A')} F^{(A')\mu\nu} - \frac{\epsilon}{2} F_{\mu\nu}^{(\text{em})} F^{(A')\mu\nu} + \frac{m_{A'}^2}{2} A'_{\mu} A'^{\mu}$$

# 数値計算結果 (ALPs)

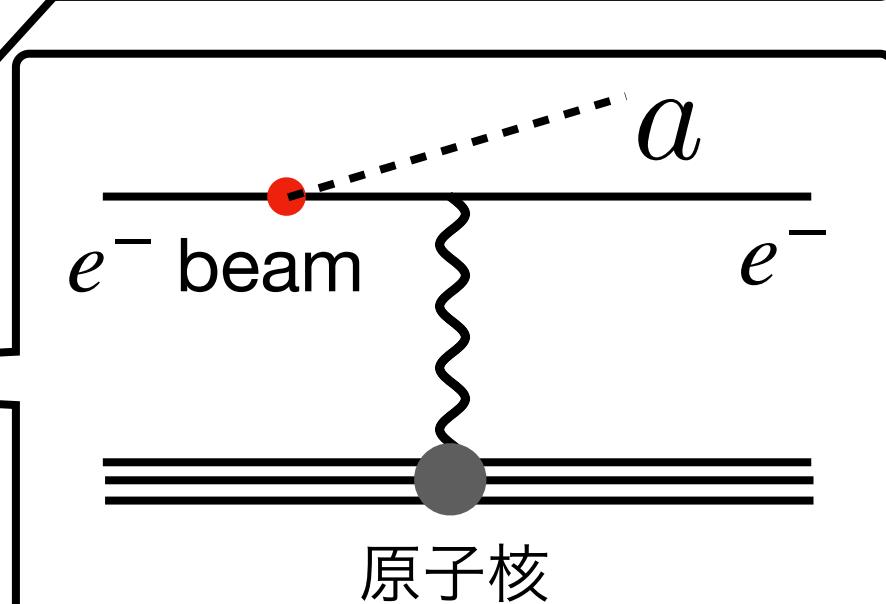
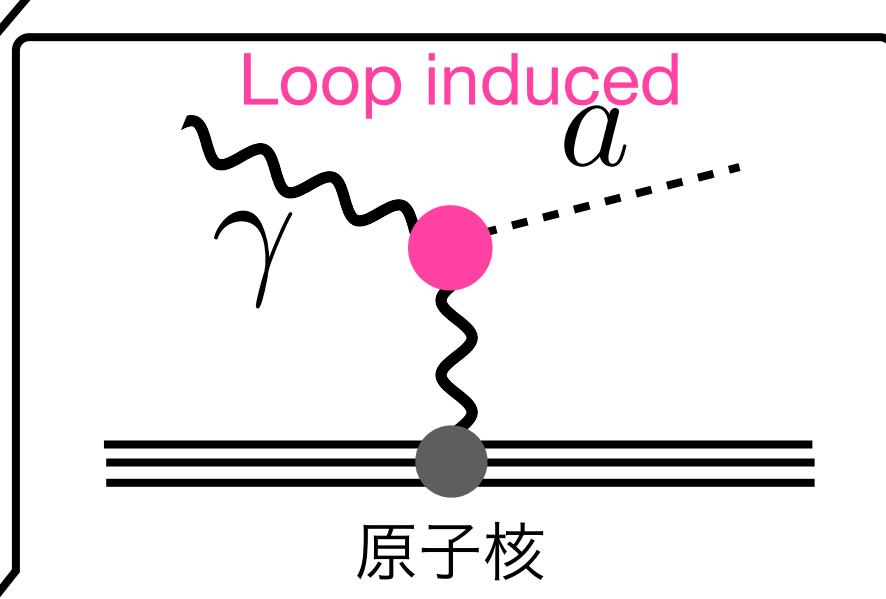
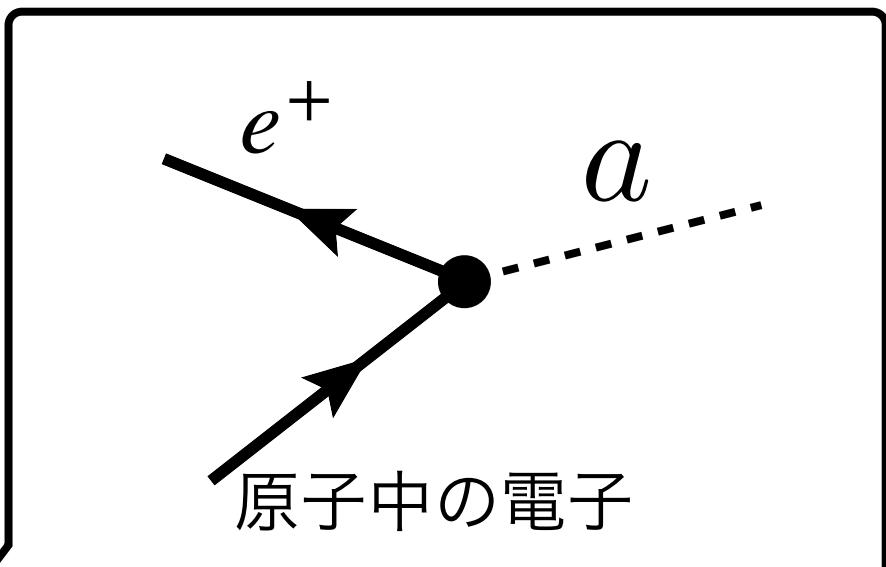
電子ビームダンプ実験



陽電子ビームダンプ実験



Model:  $\mathcal{L} \supset \frac{1}{2}\partial_\mu a\partial^\mu a - \frac{1}{2}m_a^2 a^2 + \frac{1}{2}c_{aee}\frac{\partial_\mu a}{\Lambda}\bar{e}\gamma^\mu\gamma_5 e$  -  $\frac{1}{4}g_{a\gamma\gamma}aF_{\mu\nu}\tilde{F}^{\mu\nu}$

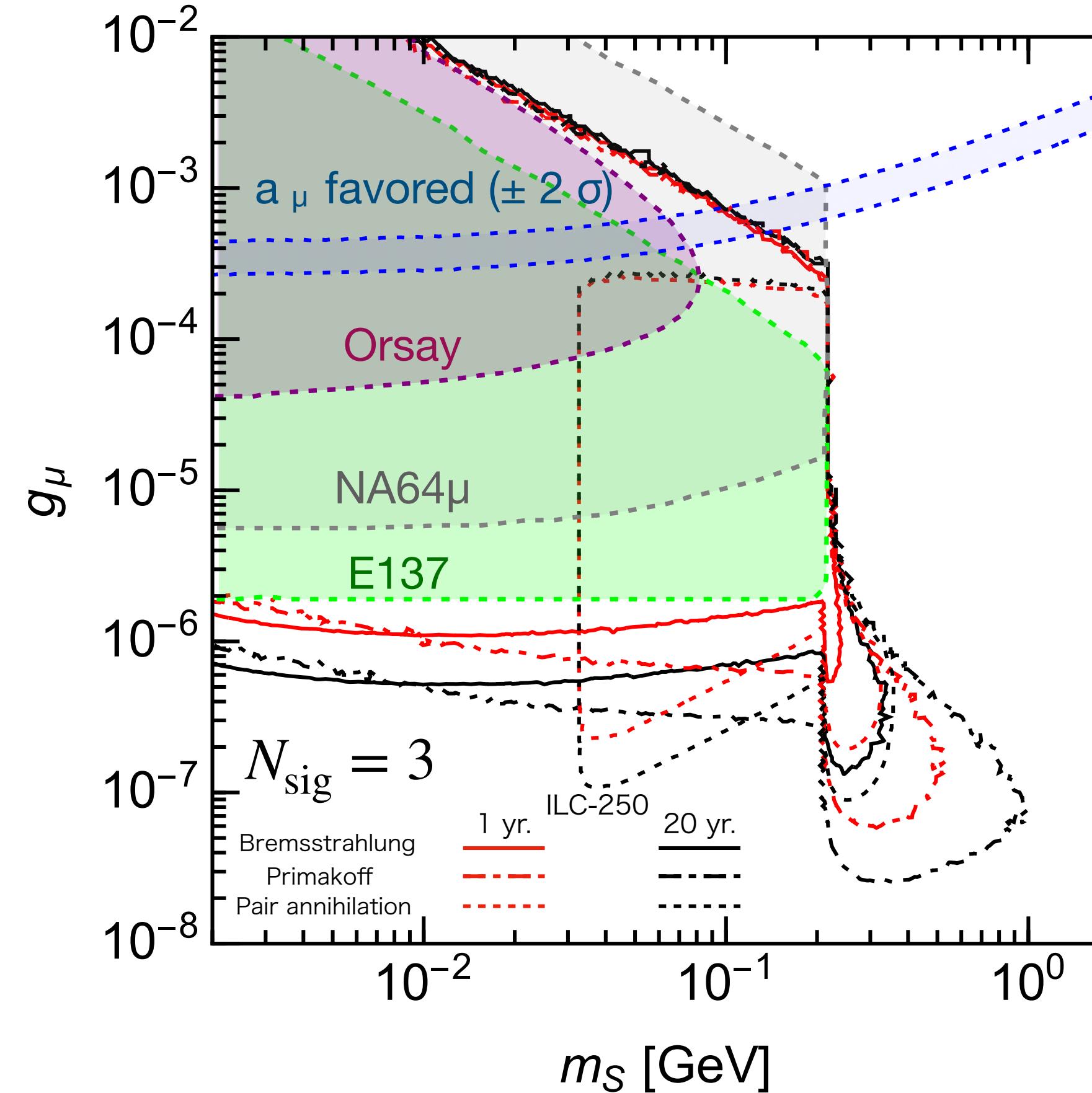


Loop induced

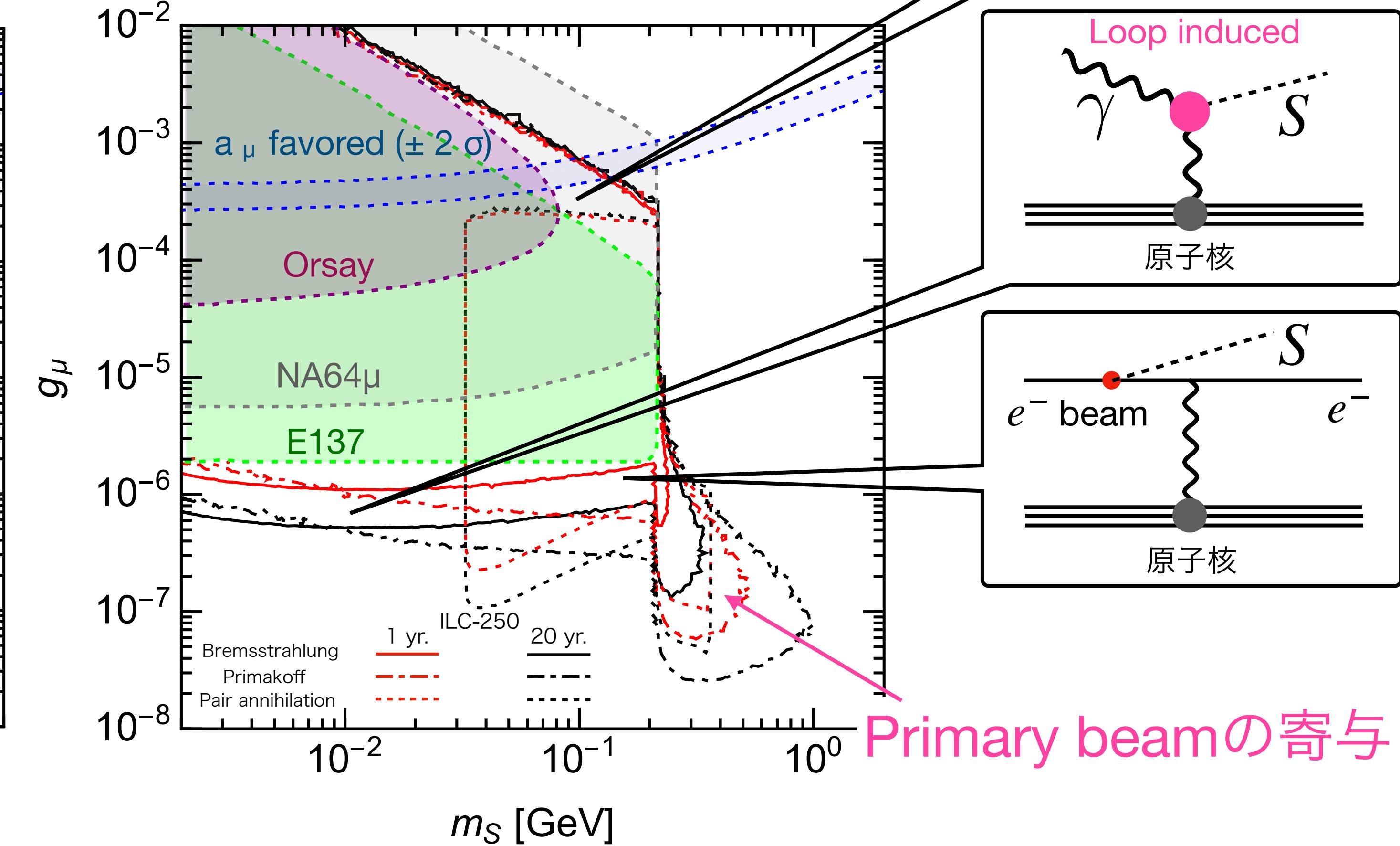
$$-\frac{1}{4}g_{a\gamma\gamma}aF_{\mu\nu}\tilde{F}^{\mu\nu}$$

# 数値計算結果 (Light scalar boson)

電子ビームダンプ実験



陽電子ビームダンプ実験



Model:  $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu S)^2 - \frac{1}{2}m_S^2 S^2 - \sum_{\ell=e,\mu,\tau} g_\ell S \bar{\ell}\ell - \boxed{\frac{1}{4}g_{S\gamma\gamma} SF_{\mu\nu} F^{\mu\nu}}$

$g_e/m_e = g_\mu/m_\mu = g_\tau/m_\tau$

# Summary

- Fixed-Target実験はSMとの結合定数が小さく質量の小さな粒子を含む理論に感度をもつ
- ILC beam dump実験ではアクセプタンスによって、小さな結合定数や大きな結合定数の感度が決まる
- Primary陽電子ビームはbeam dump中の電子と対消滅し陽電子ビームダンプ実験が重要になりうる
- Dark photon, ALPs, light scalar bosonについてILC 陽電子電子beam dump実験の比較を行なった
- ILC beam dump実験は過去のbeam dump実験の感度を一桁程度感度が良いことがわかった